修士論文

T2Kニュートリノ振動実験における ニュートリノビームの測定と

ビーム形状に起因する系統誤差の評価

京都大学大学院

理学研究科 物理学 · 宇宙物理学専攻 物理学第二教室 高エネルギー物理学研究室 鈴木 研人

平成 23 年 2 月 22 日

概 要

長基線ニュートリノ振動実験 T2K では茨城県東海村にある大強度陽子加速器施設 J-PARC にある陽子シン クロトロン (設計強度:750kW)において生成されたミューオンニュートリノビームを 295km 離れた Super-Kamiokande(SK)によって観測して電子ニュートリノ出現モードの発見による θ_{13} の測定、及びミューオン ニュートリノ消失モードによる $\theta_{23} \ge \Delta m_{23}^2$ の精密測定、を行う。この T2K 実験で稼働中のミューオンモニ ターはミューオンニュートリノと共に生成されるミューオンの強度及び方向を測る事で、常にニュートリノ ビームの方向と強度をモニターできる。2010年1月より始まった物理ランではこのミューオンモニターの測 定結果により、多くのデータが物理データとして用いられる事を保証した。本論文ではまずこのミューオン モニターで得られたビームデータの解析結果について述べる。また、ニュートリノビームの形状を評価する ために、2010年の秋に導入した INGRID shoulder module の性能評価を行った。そして、ビームデータ解析に よりニュートリノのビーム形状を評価した。続いてシミュレーションを用いてニュートリノビームの形状を 変え、後置検出器 Super-Kamiokande におけるニュートリノフラックスにどれだけの系統誤差を与えるのかを 見積もった。そして最後に、シミュレーションで評価したニュートリノビームの形状とデータとの比較行っ たのでこれについて述べる。

目次

第1章	序論	4
1.1	ニュートリノの物理	4
	1.1.1 ニュートリノの発見	4
	1.1.2 ニュートリノの質量	5
	1.1.3 ニュートリノ振動	6
1.2	長基線ニュートリノ振動実験 T2K	8
	1.2.1 物理目標	8
	1.2.2 実験の特色	9
1.3	本論文の目的	10
第2章	T2K 実験の概要	12
2.1	大強度陽子加速器施設 J-PARC	12
2.2	ニュートリノビームライン	14
	2.2.1 ビームライン磁石	15
	2.2.2 陽子ビームモニター	15
	2.2.3 バッフル	17
	2.2.4 OTR	17
	2.2.5 標的	18
	2.2.6 電磁ホーン	18
	2.2.7 崩壊トンネルとビームダンプ	19
2.3	前置検出器:ND280 オフアクシス&INGRID	19
	2.3.1 ND280 オフアクシス	19
	2.3.2 INGRID	20
2.4	後置検出器:Super-Kamiokande	21
第3章	T2K ミューオンモニター	23
3.1	ミューオンモニターへの要請	23
3.2	ミューオンモニターの構成	25
	3.2.1 平行平板型イオンチェンバー	26
	3.2.2 シリコン PIN フォトダイオード	33
	3.2.3 エレクトロニクス	35
3.3	キャリブレーション	36
	3.3.1 エレクトロニクスキャリブレーション	36

	3.3.2 ビームを使った検出器キャリブレーション	38
第4章	T2K ニュートリノモニター INGRID Shoulder Module	43
4.1	T2K ニュートリノモニター	43
	4.1.1 INGRID	43
	4.1.2 INGRID shoulder module	46
4.2	INGRID shoulder module の製作	46
	4.2.1 MPPC ノイズ評価	48
	4.2.2 宇宙線を用いた光量評価	53
	4.2.3 組み立て作業・インストール	61
第5章	ミューオンモニターを用いた T2K 実験データ解析	63
5.1	解析方法	65
5.2	Good spill selection	67
5.3	2010a データ解析	68
	5.3.1 強度·方向測定分解能	68
	5.3.2 電磁ホーン電流の依存性	69
	5.3.3 運転時のトラブル	76
	5.3.4 ビームの安定性	76
5.4	夏のシャットダウンに行われたミューオンモニターアップグレード	79
	5.4.1 Attenuator の変更	79
	5.4.2 電圧印加回路の変更	79
5.5	2010b データ解析	81
	5.5.1 2010a からの変化	85
	5.5.2 方向·強度測定分解能	94
	5.5.3 ビームの安定性	94
5.6	ミューオンビームの形状	96
第6章	ニュートリノビーム形状からくる系統誤差の評価	98
6.1	INGRID shoulder module を用いた 2010b データ解析	98
	6.1.1 インストール後のチャンネルチェック	98
	6.1.2 ニュートリノイベントセレクション	98
	6.1.3 データ解析	101
6.2	非軸対称なビーム形状からくる SK におけるニュートリノフラックス (Φ _{SK}) の系統誤差	110
	6.2.1 陽子ビームの Re-weighting	110
	6.2.2 Φ_{SK} の不定性	113
6.3	シミュレーションを用いたビーム形状評価	116
	6.3.1 シミュレーションを用いた INGRID sholder module におけるビーム形状評価	116
	6.3.2 データとシミュレーションの比較	117
6.4	本章のまとめ	121

付録D	T2K 実験の現状	135
C.2	ニュートリノ反応シミュレーション:NEUT	133
C.1	T2K ビームラインシミュレーション: JNUBEAM	133
付録C	シミュレーション	133
付録B	MPPC の特性	132
付録A	半導体検出器の特性	125
第7章	結論	123

第1章 序論

1.1 ニュートリノの物理

現在の素粒子標準模型の枠組みでは、ニュートリノは以下のような性質を持っているとされている。

- スピン 1/2 の Dirac 粒子
- 電気的に中性で弱い相互作用 (荷電カレント (CC) 反応、中性カレント (NC) 反応) を行う
- 3世代ある (v_e v_µ v_τ)

ニュートリノはフェルミオンであるが、これらを見ても、他のクォークやレプトンと比べても異質である 事がわかる。まず、このニュートリノが発見されるに至った過程を述べ、ニュートリノ振動を通して発見さ れたニュートリノの質量について触れた後、我々が取り組んでいるニュートリノ振動について述べる。

1.1.1 ニュートリノの発見

ニュートリノ発見の歴史の発端となったのは、1911年に行われた β 崩壊実験であった。当時 β 崩壊はある 原子核がそれより軽い原子核と電子に崩壊する2体崩壊と考えられ、測定される電子のエネルギースペクト ルは一本のピークが立つような分布になると予測されていた。しかし、実際測定してみると2体崩壊では説 明できないような連続スペクトルとなっていた。これを見て Pauli は 1930年に電気的に中性な粒子「ニュー トロン」の存在を提案したが、1932年に Chadwick によって中性子が発見され、ニュートロンの名はこちら に用いられることになる。しかし、さらにその2年後の1934年、Fermi は初めて β 崩壊についての理論を発 表した。Fermi は Pauli が行った β 崩壊を次のような反応によって起こるものと考えた。

$$n \to p + e^- + \nu \tag{1.1}$$

そして、この*v*を彼は「ニュートリノ」と名付けた。今日我々の知るニュートリノという名はここから用 いられ始めたのである。

1959 年、Reines と Cowan [1] により、世界で初めてニュートリノが発見された。この実験はアメリカの ジョージア州にある Savanna River Plant にある Reactor を用いて行われた。そして彼らは以下の逆β崩壊反 応を探った。

$$\bar{v_e} + p \to e^+ + n \tag{1.2}$$

まず、核分裂反応によって生じた Reactor からの反ニュートリノを、標的である水に CdCl₂ を溶かしたものと反応させる。式 (1.2)の反応で生じた陽電子の対消滅からの 2γ (First signal) と、中性子が Cd に捕獲されたことによって生じる γ (Second signal)の信号との遅延コインシデンスをとり、データを蓄積した。図 1.1 はこれら検出原理の模式図を表す (参考文献 [1]より引用)。その結果、1時間あたり3イベントのシグナルを発見し、反ニュートリノの検出に成功した事を証明した。



図 1.1: 反ニュートリノ検出における模式図。Reactor からの反ニュートリノを標的 (CdCl₂+H₂O) と反応させ、 陽電子の対消滅から生じる 2y と中性子が Cd に捕獲されて生じる y を液体シンチレータで検出し、これらの 遅延コインシデンスをとることで反ニュートリノ検出を行った [1]。

1.1.2 ニュートリノの質量

さて、標準模型においてはニュートリノは質量が無いと考えていた。そのため、そのヘリシティ(= $\frac{\vec{\sigma}\cdot\vec{p}}{|\vec{\rho}|}$ 、 $\vec{\sigma}$ はスピン、 \vec{p} は運動量) は ±1 (+1: Right Hand (RH)、-1: Left Hand (LH)) である。さらに、標準模型ではニュー

トリノはただ1つのヘリシティしかとれないとされている。つまり、

$$v = v_L \text{ (LH)} \tag{1.3}$$

$$\bar{\nu} = \bar{\nu}_R \ (\text{RH}) \tag{1.4}$$

標準模型において、ゲージ場は Higgs 機構によって質量が与えられるとされる。レプトン場のラグランジアン密度を *l*_L(LH)、*l*_R(RH) とすると、そのラグランジアンを計算した際、ヒッグス機構により、質量項が以下のように生じる。

$$L_{mass} = \sqrt{2\lambda v^2} l_L l_R$$

= $m l_L l_R$ (1.5)

ここで、vは Higgs 場の真空の期待値、 λ は無次元の結合定数としている。すると、ニュートリノは LH (反 ニュートリノなら RH) しか存在しないので上の式はゼロとなり、確かにニュートリノの質量は得られない。 しかし、もしニュートリノがマヨナラ ($v \equiv \bar{v}$) ならば、次に述べる 2 重 β 崩壊実験を通して、質量の存在を証 明できる。

2 重 β 崩壊の実験では ⁷⁶Ge や ⁸²Se などの放射性物質を用いて 2 重 β 崩壊を起こさせ、次の反応をシグナ ルとする。

$$2n \to 2p + 2e^- \tag{1.6}$$

これの内訳は次のようになっている。

1.
$$n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_{eR}$$

2. $\bar{v}_{eR} (\equiv v_{eR}) + n \rightarrow p + e^{-}$

vの添字 R は RH を意味する。2. の反応が起こるためにはニュートリノはマヨナラ ($v \equiv \bar{v}$) であり、かつへ リシティFlip を起こさなければいけない。すなわちニュートリノに質量がないと起こらない。したがって、こ の反応モードが発見されればニュートリノがマヨナラ粒子である証拠となり、かつニュートリノの質量はゼ ロではない事がわかる。

1.1.3 ニュートリノ振動

ニュートリノに質量があるのではないかと最初に疑問を持ったのは Bruno Pontecorvo であった。彼は、も し質量があるとするのであれば、時間の経過と共にニュートリノと反ニュートリノ間で振動をするという 「ニュートリノ振動」を唱えた。そしてその後、牧・中川・坂田によりこの「ニュートリノ振動」は次のよう に考えられた。それは、ニュートリノが質量を持つ事により、弱い相互作用の固有状態が質量固有状態の混 合状態で表され、フレーバー間で振動をする、という内容である。ここでは、このニュートリノ振動につい て述べていく。

もし、ニュートリノに質量があるとすれば、弱い相互作用の固有状態は質量固有状態の混合状態で記述される。今、時刻t = 0 で v_{α} が生成したとする。

$$|\nu(t=0)\rangle = |\nu_{\alpha}\rangle = \sum_{i=1}^{3} U_{\alpha i} |\nu_{i}\rangle$$
(1.7)

ここで $\alpha = e$ 、 μ 、 τ 、 $|v_i\rangle$ は質量 m_i の固有状態である。U は牧 · 中川 · 坂田行列 (MNS 行列) と呼ばれ [2]、 以下のようになっている。

$$U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & e^{i\delta}s_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ -e^{-i\delta}s_{13} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
(1.8)

 $c_{ij} = \cos \theta_{ij}, s_{ij} = \sin \theta_{ij}, \delta$ は CP 非保存の位相である。続けて、質量固有状態 ($|v_i\rangle$) の時間発展を考えて いく。時刻 *t* では、式 (1.7) の $|v_i\rangle$ の各成分は、

$$|v_i(t)\rangle = e^{-i(E_i t - p_i L)} |v_i\rangle \tag{1.9}$$

となる。ここで、 E_i 、 p_i はそれぞれエネルギーと運動量で、Lは時刻 tにおけるニュートリノの飛行距離とする。また、ここでは自然単位系 ($\hbar = c = 1$)を使用している。

もし、質量が十分に小さい $(m_i \ll E_i)$ ならば、その運動量を p_i として、

$$E_i \simeq p_i + \frac{m_i^2}{2p_i} \tag{1.10}$$

と近似でき、さらにニュートリノはほぼ光速に近い (t ≃ L) とすると、式 (1.8) は、

$$|\nu_i(L)\rangle = e^{-i\frac{m_i^2}{2E_i}L}|\nu_i\rangle \tag{1.11}$$

と、飛行距離の関数となる。したがって、距離Lではニュートリノの弱い相互作用の固有状態は式(1.7)より、

$$|\nu(L)\rangle = \sum_{i=1}^{3} U_{\alpha i} |\nu_i(L)\rangle = \sum_{i=1}^{3} U_{\alpha i} e^{-i\frac{m_i^2}{2E}L} |\nu_i\rangle$$
(1.12)

となる。ここではある決まったエネルギーを考え、 $E_i = E$ とした。これより、ニュートリノが距離 L を飛んだ時、フレーバーが $\alpha \rightarrow \beta$ となる確率 P は実数部分と虚数部分に分けて次のように書ける。

$$P(\nu_{\alpha} \to \nu_{\beta}) = |\langle \nu_{\beta} | \nu_{\alpha}(L) \rangle|^{2}$$

$$= |\sum_{i=1}^{3} U_{\alpha i} e^{-i\frac{m_{i}^{2}}{2E}L} U_{\beta i}^{*}|^{2}$$

$$= \delta_{\alpha\beta} - 4 \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} Re(U_{\alpha i} U_{\beta i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) \sin^{2} \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{4E}\right) \pm 2 \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{3} Im(U_{\alpha i} U_{\beta i}^{*} U_{\beta j}^{*} U_{\alpha j}) \sin \left(\frac{\Delta m_{ij}^{2}L}{2E}\right)$$
(1.13)

ここで、 $\Delta m_{ij} = m_i^2 - m_j^2$ は質量二乗差で、虚数部分前の符号 ± はニュートリノ (+) と反ニュートリノ (-) を分別する意味で用いている。もし、式 (1.8) 内の δ がゼロでなければこの虚数部分の項もゼロでなくなり、 $P(\nu_{\alpha} \rightarrow \nu_{\beta}) \neq P(\bar{\nu}_{\alpha} \rightarrow \bar{\nu}_{\beta})$ 、つまり CP の破れが生じる。これが、 δ が CP 非保存の項と呼ばれる所以である。

ニュートリノ振動の実験的証拠が得られたのは 1998 年の Super-Kamiokande の大気ニュートリノの天頂角 分布の測定 [3] であった。その後、加速器を用いて人工的に生成したニュートリノを用いた K2K 実験 [4] で も、ニュートリノ振動を確認して以降、今日まで多くのニュートリノ振動実験が行われてきた。そして、こ れらの実験結果により現在、 $\Delta m_{31}^2 \sim 2.4 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ 、 $\Delta m_{23}^2 \sim 2.5 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ 、 $\Delta m_{12} \sim 7.65 \times 10^{-5} \text{ eV}^2$ 、また $\theta_{23} \simeq 45^\circ$ である事が分かっている。質量 2 乗差に関しては、近似的に $\Delta m_{23}^2 \sim \Delta m_{31}^2 \gg \Delta m_{12}^2$ と表す事ができ るので、これを用いて式 (1.16) は、特に ν_{μ} の振動確率については以下のように簡単に表記できる。

$$P(\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}) \simeq \sin^{2} 2\theta_{13} \cdot \sin^{2} \theta_{23} \cdot \sin^{2} \left(\frac{\Delta m_{23}^{2}L}{4E}\right)$$

$$\equiv \sin^{2} 2\theta_{\mu e} \cdot \sin^{2} \left(\frac{\Delta m_{23}^{2}L}{4E}\right)$$

$$P(\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\mu}) \simeq 1 - \sin^{2} 2\theta_{23} \cdot \cos^{4} \theta_{13} \cdot \sin^{2} \left(\frac{\Delta m_{23}^{2}L}{4E}\right)$$

$$\equiv 1 - \sin^{2} 2\theta_{\mu \tau} \cdot \sin^{2} \left(\frac{\Delta m_{23}^{2}L}{4E}\right)$$
(1.15)

ここで、 $\sin^2 2\theta_{ve} \equiv \sin^2 2\theta_{13} \cdot \sin^2 \theta_{23}$ 、 $\sin^2 2\theta_{v\tau} \equiv \sin^2 2\theta_{23} \cdot \cos^4 \theta_{13}$ である。次で述べるが、現在我々が行っている T2K 実験ではミューオンニュートリノを用いた振動実験を行っている。そして、世界最高の統計量を用いて、式 (1.14)、(1.15) に現れる振動パラメータの測定を行っているのである。

1.2 長基線ニュートリノ振動実験 T2K

2009 年春より開始した T2K [5] (Tokai to Kamioka) は茨城県那珂郡東海村と岐阜県神岡間の 295 km を結ぶ 長基線ニュートリノ振動実験である。東海村にある J-PARC (Japan Proton Accelerator Complex) のメインリン グで加速した陽子を用い、 ν_{μ} を生成させ、神岡に位置する Super-Kamiokande によって検出する (図 1.2。実 験で用いられる施設や検出器の概要については第2章で述べるとして、ここでは T2K 実験の物理目標とその 実験の特色について述べる。

1.2.1 物理目標

T2K 実験の物理目標は主に以下の2点である。

・電子ニュートリノ出現事象の観測による θ₁₃ の測定
 現在、ニュートリノの混合角 θ₁₃ は CHOOZ [6] によって上限値がつけられているに過ぎず、その値は



図 1.2: T2K 実験の模式図。J-PARC のある東海から 295 km 離れた SK(神岡) へとニュートリノビームを送る。

 $\sin^2 2\theta_{13} < 0.15(90\% C.L)$ ($\Delta m_{23}^2 = 2.4 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$)である。T2K 実験では電子ニュートリノ事象 ($\nu_\mu \rightarrow \nu_e$) の探索を通して、 θ_{13} に対する感度を 20 倍近くあげる。そして、

$$\sin^2 2\theta_{\mu e} \simeq \frac{1}{2} \sin^2 2\theta_{13} > 0.004 \quad (\delta = 0)$$

を目指す。

• ミューオンニュートリノ消滅事象による θ_{23} 、 Δm_{23}^2 の精密測定 高い統計量を用いて、ミューオンニュートリノ消滅事象 ($\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$)により、これまでにない感度で振動 パラメータを測定し、

$$\delta(\Delta m_{23}^2) \sim 10^{-4} \text{eV}^2$$
$$\delta(\sin^2 \theta_{23}) \sim 0.01$$

を目指す。

1.2.2 実験の特色

以下にT2Kの特色を挙げる。

- 世界最大強度のニュートリノビーム強度
 J-PARCの30GeV 陽子シンクロトロンを用い、最高強度750 kWの陽子ビームを用いる事で、一度に大量のニュートリノビームを生成する。
- 世界最大級の水チェレンコフ検出器: Super-Kamiokande
 後置検出器に世界最大級の水チェレンコフ検出器である「Super-Kamiokande (SK)」を用いる。
- ・ Off-Axis 法 T2K 実験では陽子ビームを炭素標的に当て、2 次粒子である π 中間子の 2 体崩壊 ($\pi \rightarrow \nu_{\mu} + \mu^{+}$) ミュー

オンニュートリノを用いる。この時、ニュートリノのエネルギー (E_{ν}) は親 π の方向からのずれを θ と すると、簡単な運動学によって次の式のように表せる。

$$E_{\nu} = \frac{m_{\pi}^2 - m_{\mu}^2}{2(E_{\pi} - p_{\pi}\cos\theta)}$$
(1.16)

ここで、 E_{π} 、 p_{π} 、 m_{π} はそれぞれ π 中間子のエネルギー、運動量、質量を表し、 m_{μ} は μ 粒子の質量である。式 (1.16) を用いて、ニュートリノエネルギーと π の運動量の関係をプロットしたのが図 1.3 である。これを見ると、 $\theta=0^{\circ}$ ではニュートリノエネルギーは π の運動量に比例していくのに対し、 $\theta=2.0$ 、2.5、3.0°ではほぼ単色となるのがわかる。

T2K 実験ではこの効果を利用するため、世界で初めて Off-Axis 法を選択した。この Off-Axis 法では ニュートリノのビーム軸を SK の方向に合わせる (On-Axis) 事をせず、SK 方向から 2.5°(式 1.16 中の θ の値) ずらしている。これによって、SK において、ニュートリノの振動確率が最大 (0.5-0.7 GeV 付近) となるような幅の狭いニュートリノスペクトルが得られ、バックグランド事象を起こす高いエネルギー のニュートリノの数を抑える事ができるのである (図 1.4)。



図 1.3: ニュートリノエネルギーとπの運動量の関係。ニュートリノの生成角がπに対してずれていくとほぼ 単色なエネルギーとなる。

1.3 本論文の目的

本論文の目的は大きく分けて以下の2つに分かれる。

T2K 物理ビームデータの品質を保証
 T2K の最初の物理ランのビームデータ解析をミューオンモニターを用いて行った。その結果多くのビームデータが振動解析に用いる物理データとして使用できる事を保証した。

ビーム形状の評価とビームの非軸対称性からくる SK におけるニュートリノフラックスのスタディニュートリノビームの形状を評価するために導入した INGRID shoulder module のデータ解析を行い、実際の形状を評価した。また、シミュレーションを用いて、ニュートリノビームを非軸対称の形にしてSK におけるニュートリノフラックスの不定性を見積もった。最後にビーム形状について、データとシミュレーションの比較を行った。

以上について述べる。



図 1.4: Off-Axis 法の効果。Off-Axis 法によって SK におけるニュートリノ振動確率が最大となるような幅の 狭いニュートリノエネルギースペクトルを得られる。

第2章 T2K実験の概要

T2K 実験の主な施設は以下の通りである。

- J-PARC MR
- ニュートリノビームライン
- 前置検出器 (ND280、INGRID)
- Super-Kamiokande

この章ではこれら施設の概要について述べていく。

2.1 大強度陽子加速器施設 J-PARC

J-PARC(Japan Proton Accelerator Research Complex) は茨城県那珂郡東海村に位置する加速器施設である。 そこでは、高エネルギー陽子を炭素標的と衝突させることによって生じる2次粒子を利用して、様々な実験 が行われている。図 2.1 は J-PARC の構図である。J-PARC は複合型加速器施設であり、

- 線形加速器 (LINAC)
- 3 GeV RCS (Rapid-Cycling Synchrotron)
- 50 GeV MR (Slow-Cycling Main Ring Synchrotron)

の3つの加速器から構成されている。

まず LINAC にて、イオン源で 25 Hz 周期で発生させた H⁻ イオンを 181MeV(設計値は 400MeV) まで加速 させる。加速された H⁻ イオンは荷電変換フォイルによって陽子に変換され、RCS に入射する。RCS では計 2つの陽子ビームの塊(以降、バンチという)を 3GeV まで加速し、25 Hz 周期で取り出している。中性子利用 施設「MLF」ではこの RCS で取り出された 95%以上の 3GeV 陽子を利用し、2次粒子である中性子を用いた 実験が行われている。さて、残りの 5%の陽子は最下流に位置する MR に入射され、30GeV(設計値は 50GeV) まで加速される。MR では RCS から 25 Hz で受け取った陽子を 2バンチずつ、4 回受け取り、計 8 バンチ (ま とめて 1 スピルという)の陽子ビームを加速させている。そして、加速した陽子ビームは速い取り出し (Fast Extraction: FX) でニュートリノビームラインへと輸送される。一方遅い取り出し (Slow Extraction: SX) によ りハドロン実験施設に輸送される。T2K 実験では速い取り出しによってニュートリノビームラインに輸送さ れた陽子ビームを用いている。表 2.1 に FX で取り出された陽子ビームのパラメータを、図 2.2 にはその陽子 ビームのバンチ構造を示す。



図 2.1: J-PARC の構図。線形加速器、RCS、MR の3つの加速器から構成されている。



図 2.2: 速い取り出しで取り出されるバンチ構造。スピル周期は 3.2 s(2010 年 6 月までは 3.52 s) であり、1 ス ピル当たりのバンチ数は 8 バンチ (2010 年 6 月までは 6 バンチ) である。また、バンチ間隔は 581 ns で、バ ンチ幅は 58 ns となっている。

表 2.1: T2K 実験で用いている陽子ビームのパラメータ

陽子ビームエネルギー	30 GeV
ビームパワー	115 kW (2010 年 12 月現在)
	設計值: 750 kW
スピル周期	3.52 s (~2010 年 6 月)
	3.2 s (2010年11月~)
バンチ数	6 / spill (~2010 年 6 月)
	8 / spill (2010 年 11 月 ~)
バンチ間隔	581 ns
バンチ幅	58 ns

2.2 ニュートリノビームライン

MRのFXで取り出された陽子ビームは続いてニュートリノビームライン (図 2.3) へと輸送される。ここではニュートリノビームラインのコンポーネントについて述べていく。



図 2.3: ニュートリノビームライン

2.2.1 ビームライン磁石

ニュートリノビームを SK に送り出す必要があるが、そのためにはまず 90° 近く陽子ビームを曲げなけれ ばならない。そのため、この図 2.3 内に記されている Primary beam line (1 次ビームライン) 内では 2 極磁場 2.6 T と 4 極磁場 19 T/m を同時に発生できる複合磁場型超伝導磁石 28 台を設置している。そして、1 次ビー ムライン最終部 (図 2.3 内 (3)) では 10 台の常電動磁石により、ビームを下向きに 3.637° 曲げ、SK への方向 にビームを調整している。

2.2.2 陽子ビームモニター

陽子ビームが炭素標的に照射されるまでは、陽子ビームモニターを用いて、磁石による軌道及びプロファ イル幅の調整を行っている。T2K実験で用いている陽子ビームモニターは以下の通りである。

- ビーム強度モニター: CT
- ビームポジションモニター: ESM
- ビームプロファイルモニター: SSEM
- ビームロスモニター: BLM

図 2.4 にはこれらモニターの写真を載せている。

ビーム強度モニター: CT

ビーム強度モニター、CT (Current Transformer) は強磁性体をコアとしたトロイダルコイルを用いた電流ト ランスである (図 2.4(a))。ビームが CT を通過する際に発生するトロイダル磁場によって生じる誘導電流を信 号として読み出す。ニュートリノビームライン中には計 5 台の CT が設置されている。

ビームポジションモニター: ESM

ビームポジションモニター、ESM(ElectroStatic Beam Position Monitor) はビーム軸周りの四方に電極を備え ており、ビームが通過した際、それぞれの電極に誘起する電荷量を測定する検出器である (図 2.4(b))。上下と 左右それぞれで誘起信号量の違いを見る事で、ビームが通過した位置を求める。ニュートリノビームライン 中には計 21 台の ESM が設置されている。

ビームプロファイルモニター: SSEM

ビームプロファイルモニター、SSEM(Segmented Secondary Emission Monitor) はストリップ上の金属薄膜 を並べて、ビームが通過した際に放出する2次電子量を測定し、ビームプロファイルを測定する検出器であ る (図 2.4(c))。図 2.5 には SSEM の動作原理を載せてある。ストリップがそれぞれ鉛直方向と水平方向の2種 類の向きに並べられた計2枚の信号プレーンを有し、これによりそれぞれの方向におけるビームプロファイ ルが測定可能である。ニュートリノビームライン中には計19台の SSEM が設置されている。



(a) CT



(b) ESM



(c) SSEM



(d) BLM

図 2.4: 陽子ビームモニターの写真



図 2.5: SSEM の動作原理

ビームロスモニター: BLM

ビームロスモニター、BLM(Beam Loss Monitor) はアルゴンをベースとしたガスワイヤープロポーショナル チェンバーである (図 2.4(d))。これをビームパイプの近くに設置し、ビームのロスを測っている。大きなビー ムロスが起きた時、他のビームライン機器を故障させるばかりでなく、放射化によりメンテナンス作業に支 障をきたす恐れがある。そのため、BLM によってビームロスを計測し、大きなビームロスが起きた場合はす ぐさまビームを止める。また、ビームロスが少なくなるようにビーム調整の軌道を促している。ニュートリ ノビームライン中には計 50 台の BLM が設置されている。

2.2.3 バッフル

バッフルは長さ 1.7 m、幅 0.3 m、高さ 0.4 m の炭素ブロックであり、中心には直径 30 mm の穴が空いている。次で述べる OTR の直前に置かれており、ビームがずれた時の下流の機器の保護をするためのコリメータの役割を果たしている。

2.2.4 OTR

OTR (Optical Transition Radiation Monitor) は SSEM と同様、陽子ビームのプロファイル測定をする検出器 であり、炭素標的の直前に設置されている。OTR には 8 枚入るフォイルスロット (図 2.6) を有している。主 に以下のフォイルを使用している。

• 蛍光フォイル (1 スロット)

- アルミニウムフォイル(1スロット)
- 厚さ 50 µm のチタン合金フォイル (4 スロット)

ビーム強度が高くなるにつれ、蛍光、アルミニウム、チタン合金のフォイルへと変えていく。その他にグ リッド上の較正用フォイルに1スロット割り当てられていて、残りの1スロットは空となっている。フォイ ルはビーム軸から 45° 傾けて設置されていて、ビームが金属のフォイルを通過すると可視光領域の遷移放射 を起こす (図 2.7)。後方散乱の光のみをミラーで CCD カメラまで輸送している。CCD カメラに読み込まれ た光の強度は元の陽子ビームのプロファイルを再現するよう 2 次元ピクセル状にプロットされ、これにより ビームのプロファイルを割り出している。



2.2.5 標的

標的は直径 26mm、長さ 91.4mm の炭素で出来ている。標的の周りは陽子ビーム照射による発熱を冷却す るため、1.6 atm のヘリウムガスを流している。

2.2.6 電磁ホーン

陽子ビームが炭素標的に照射した際に生じる π 中間子を前方へ収束させ、SK におけるニュートリノのフ ラックスを増やすために、T2K では3台の電磁ホーンを導入している。電磁ホーンはアルミニウム合金の同 軸構造をとっていて、これに電流を流すことによってトロイダル磁場を内部に形成している。第1電磁ホー ン(以下ホーン1と呼ぶ)(図 2.8)は炭素標的の周りに設置されていて、長さは 1.5 m である。また第2、第3 電磁ホーン(以下ホーン2、ホーン3と呼ぶ)はそれぞれ長さが2 m、2.5 m となっている。ホーンの配置図を 図 2.9 に示す。全てのホーンに最大 320 kA のパルス電流を流すことで、最大 2.1 T の磁場を得られ、SK に おけるニュートリノフラックスはホーン電流が無い時と比べエネルギースペクトルのピーク位置で 16 倍増え ると予想される。

2.2.7 崩壊トンネルとビームダンプ

電磁ホーンによって収束した π 中間子は続いて崩壊トンネルに向かう。崩壊トンネルはヘリウムガスが充 填された鉄容器であり、長さ 96 m である。この崩壊トンネル内で $\pi \to \mu v_{\mu}$ の反応が起こり、ニュートリノ を生成する。ニュートリノビームはこの時に形成される。ビームダンプ (ハドロン吸収体) は主に鉄と炭素で 構成されている長さ 2.8 m の構造体であり、崩壊トンネルの直下流に置かれていてる。ここでは、陽子や崩 壊せずに残った π 中間子などのハドロンを吸収し、5 GeV/c 以上の運動量を持った μ 粒子のみを通過させる。 通過した μ 粒子はミューオンモニターによって検出され、ミューオンビームの強度と方向がそこで測定され る。ミューオンモニターについては第3章で詳しく述べる。





図 2.9: 電磁ホーン 3 台の配置図。左からホーン 1、2、 3 となっている。

図 2.8: ホーン1の写真

2.3 前置検出器:ND280 オフアクシス&INGRID

炭素標的から下流 280 m に位置する前置検出器ホール (図 2.10) では検出器 ND280 オフアクシスと On-Axis 検出器 INGRID が設置され、これらはニュートリノビームを測定している。

2.3.1 ND280 オフアクシス

ND280 オフアクシス (図 2.11) は SK の方向に置かれた検出器群である。これらは振動前のニュートリノの フラックス、エネルギースペクトルを次の反応モード (CC-QE) を通して測定する。

$$\nu_l + p \to l + n \tag{2.1}$$

また振動解析のバックグランドとなるような反応 (CC-1 π : $v_l + p \rightarrow l + p + \pi^+$ など)の数の測定も行う。ND280 は以下のコンポーネントからなる。

• Magnet

ND280 では UA1 マグネットを使用している。これは CERN で行われていた UA1 実験で実際に使用していた。0.2 T の磁場をかけて、検出器内で反応した荷電粒子の運動量を測定する。

Tracker

ND280 では以下の2種類の飛跡検出器を用い、ニュートリノ反応によって生じた荷電粒子の運動量を 測定している。

- TPC (Time Projection Chamber)

TPC で測定した荷電粒子の運動量を元に、ニュートリノのエネルギーを再構成する。またトラッキングとエネルギー損失も測定することで、 μ^{\pm} 、 π^{\pm} 、 e^{\pm} の粒子識別も行っている。計3台の TPC が用いられている。

- FGD (Fine Grained Detector)

FGD は TPC が交互に挟むように設置されており、計2台の FGD が用いられている。FGD は反応標的の役割があり、ニュートリノ反応によって生じた、反応点付近の全ての荷電粒子を検出し、ニュートリノ反応の識別を目的としている。片方はホドスコープ型に配置したプラスチックシンチレータバーからなっていて、もう一方は水とシンチレータの2層の構造をとっている。この2 種類の検出器の反応レートを比較することで、ニュートリノと水との反応レートを算出し、直接 SK と比較できる。

• P0D (Pi-zero Detector)

POD はマグネット内部の最上流に位置していて、鉛とプラスチックシンチレータのサンドイッチ構造と 水ターゲットにより構成されている。ここでは中性カレント反応により生じた π⁰ の反応数を測定して いる。

• ECAL (Electromagnetic Calorimeter)

ECAL は POD と Tracker の周りを囲むように設置されており、鉛とプラスチックシンチレータを交互に 重ねたもので構成されている。内部の検出器で起きたニュートリノ反応によって生じた荷電粒子 (γ 、e⁻) を検出する。ECAL は γ 線のエネルギー測定による π^0 の再構成、及び電子識別の 2 つの役割を持つ。

SMRD (Side Muon Range Detector)
 マグネットヨークの隙間にはプラスチックシンチレータが設置され、飛程測定器 SMRD (Side Muon Range Detector) として機能している。ここで横から抜ける μ 粒子を捕える。

2.3.2 INGRID

INGRID は ND280 と同じく前置検出器ホール内に設置されていて、ビーム軸 (On-Axis) の方向に設置され ている。ニュートリノビームの方向及び強度を測定する事を目的としている。INGRID については第4章で 詳しく述べる。



図 2.10: 前置検出器ホール。炭素標的から下流 280 m に位置している。

図 2.11: ND280 の構成

2.4 後置検出器: Super-Kamiokande

後置検出器である Super-Kamiokande(SK) は質量 5 万トン (有効体積 22.5 万トン)の純水を用いた大型水 チェレンコフ検出器である (図 2.12)。炭素標的から 295 km 離れた岐阜県飛騨市の神岡鉱山の地下 1000 m に 位置している。20 インチの光電子増倍管 (PMT)を水タンク内の内部に 11200 本敷き詰め、荷電粒子から発 せられるチェレンコフ光を検出し、そのリングイメージを測定する。また、水タンクの外にも PMT が敷き詰 められており (Outer detector)、これにより宇宙線起因のバックグランドを除去している。これによりその荷 電粒子のエネルギー、発生点、進行方向、及び粒子識別を行っている。



図 2.12: Super-Kamiokande

第3章 T2K ミューオンモニター

この章ではニュートリノビームの方向を測定するための検出器、T2K ミューオンモニターについて述べる。 ミューオンモニターはニュートリノ生成標的から 118 m 下流に位置していて (図 3.1)、ミューオンビームのプ ロファイルと強度を測定する検出器である。崩壊トンネルのすぐ下流に位置する長さ 3m ほどのビームダンプ により 5 GeV/c 以上の運動量を持った μ 粒子のみがミューオンモニターの位置に到達する。図 3.2 にミューオ ンモニターに到達する μ 粒子の親粒子である π 中間子の位相空間分布 (運動量と放出角の分布)を示す。尚、 これは T2K ビームラインシュミュレーション「JNUBEAM」(付録 C.1 を参照)を用いてシミュレーションし たプロットである。縦軸は π 中間子が生成した時のビーム軸に対する放出角を表していて、横軸は π 中間子 の運動量を表す。この図からわかるように、運動量が主に 5 GeV/c 以上の π 中間子からの μ 粒子がミューオ ンモニターに到達する。放出角の小さい (θ <0.02 rad) π 中間子から生成される μ 粒子は直接ミューオンモニ ターに到達し、また放出角の大きい (θ >0.02 rad) π 中間子は電磁ホーンが作るトロイダル磁場によって曲げら れ、前方へ収束するため多くの μ 粒子がミューオンモニターに到達する。そのため図 3.2 では 2 つのピーク が見えている。



図 3.1: ミューオンモニターの位置。炭素標的から 118 m 下流の On-Axis 方向に設置されている。

3.1 ミューオンモニターへの要請

T2K 実験におけるミューオンモニターへの要請は以下の通りである。

- 1. 0.3 mrad よりも良い精度でミューオンビームの方向を測定が可能であること。
- 2.3%よりも良い精度でミューオンビームの強度を測定が可能であること。
- 3. T2K ビーム強度デザイン値 (750kW)の1%以下の強度に対しても上2項目の要請を満たすこと。
- 4. バンチごとにミューオンビームの方向、そして強度の測定が可能であること。



図 3.2: ミューオンモニターに到達するμ粒子の親粒子であるπの位相分布

5. 放射線耐性に優れていること。

それぞれの要請の理由について述べる。

まず 1. の要請についてであるが、ニュートリノビームの中心方向が on-axis に対し 1 mrad ずれると SK に おけるニュートリノエネルギーのピーク値は 2% ずれ、さらにフラックスは 3%変化する。これにより生じる ミューオンニュートリノ消失モードの振動パラメータに対する系統誤差は統計誤差 ($\delta(\sin^2\theta_{23}) = 0.09, \delta(m^2_{23})$ = 5×10⁻⁵)を上回ってしまう。したがって我々は 1 mrad よりも良い精度、0.3 mrad 以内の精度でミューオン ビームの方向を監視するよう決めた。これは 3 σ 以上の確率で 1 mrad 以内であることを保証するために与え た数値である。

2. の要請だが、ミューオンモニターは前置検出器が何かのトラブルで停止した際のバックアップも兼ねて いる。したがって、この時はミューオンモニターを用いて SK におけるニュートリノフラックスを見積もらな ければいけない。その際、測定精度が 3%より悪いと、ニュートリノフラックスの 3%の変動を測定できず、 振動パラメータの系統誤差が統計誤差を上回ってしまう。したがって、3%よりも良い精度でビーム強度を測 定する必要がある。

以上2つの項目はT2Kビームの1スピル毎に測定している。したがってこれらは1スピル毎にニュートリノビームを監視しているのと同義である。

続いて 3. の要請であるが、T2K 実験試験運転の期間にデザイン値 750 kW の 1%以下の強度でビーム運転 がなされる。この試験運転の期間ではミューオンモニターの測定結果も用いてビーム軌道調整が行われる。 したがってこの 1%以下の強度に対しても精度良くミューオンビームの方向と強度を測定する必要がある。 続いて 4. の要請であるが、第 2 章でも述べたように T2K 実験のビーム構造はバンチ構造をとっている。 よってバンチごとに方向と強度を求める事が必要である。

最後に 5. の要請であるが、T2K 実験デザイン値である 750 kW にもなると、ミューオンモニターの位置で は 100 kGy/year と、非常に高い放射線下での運転となる。したがってこれに耐えなければいけない。

3.2 ミューオンモニターの構成

図 3.3 にはミューオンモニターの概観 (左図) と実際の写真 (右図) を載せた。ミューオンモニターは 2 つの 独立な検出器で構成されており、ビーム上流側 (炭素標的に近い側) には浜松ホトニクス製シリコン PIN フォ トダイオードを、下流側にはイオンチェンバーを使用している。それぞれの検出器において、49 (7 × 7) のセ ンサーが 25 cm 間隔で並んでおり、150 × 150 cm² の領域を覆っている。

後でも述べるがイオンチェンバーにはビーム強度に応じて2種類の混合ガス(Ar+2% N₂、He+1% N₂)を 使用している。放射線環境の厳しい中でも十分に稼動できるよう設計しており、1 MGy でも耐えられるよう になっている。一方シリコン PIN フォトダイオードは試験運転の際、大変重宝される。シリコン PIN フォト ダイオードからの信号の大きさはイオンチェンバーよりも大きく、Ar+2% N₂を使用した場合と比べるとお よそ 30 倍大きいためである。しかしこの検出器は放射線耐性がイオンチェンバーよりも弱く、将来的には交 換または別の検出器を使用するといった対処が必要である。

これら2つの独立な検出器を使用することで、広範囲なビーム強度に対応できるようになっている。





図 3.3: ミューオンモニター

図 3.4 にコントロールロームを含めた全貌を載せた。ミューオンモニターは NU3 と呼ばれるニュートリノ 第三設備等の地下に接地されている。シグナルケーブル及び高電圧ケーブルは地上にあるコントロールルー ムからこのミューオンモニターまで延びており、その長さはおよそ 70 m である。コントロールルームには検 出器を操作するための電圧、シグナルの読み出し回路を設置している。またイオンチェンバーに使用するガ ス流量計も設置されており、検出器キャリブレーションに用いる架台をコントロールするためのタッチパネ ルもこのコントロールルームに設置されている。検出器キャリブレーションについては 3.3.2 章で述べる。



図 3.4: コントロールルームを含めたミューンモニターの全貌図

3.2.1 平行平板型イオンチェンバー

現在 T2K 実験ではミューオンモニターとして平行平板型のイオンチェンバーを用いている。図 3.5 に実際 に使用しているイオンチェンバーの写真を載せた。また表 3.1 にはこのイオンチェンバーの特徴及び運転時 における状況をまとめてある。





図 3.5: イオンチェンバー

使用ガス	Ar + 2%N ₂ (\leq 150 kW)
使用ガス	He + $1\%N_2$ (≥ 150 kW)
有効面積	75 mm×75 mm
極板間隔	3 mm
印加電圧	200 V
ガス圧	130 kPa
温度	34 °C
酸素濃度	≤10 ppm

表 3.1: イオンチェンバーの運転条件



図 3.6: イオンチェンバーの信号読み出しのための簡単な回路

イオンチェンバーの動作原理

図 3.6 はイオンチェンバーを用いて信号読み出しを行うための簡単な回路を表している。極板間隔 d のイ オンチェンバー (電気容量: C) にはあらかじめ V₀ の電圧がかかっていたとする。そして時刻 t = 0 で正極板 から x の位置で荷電粒子によるイオン対が生成した場合を考える。この時、イオンと電子のドリフト速度は それぞれ次のようになる。

$$v^{+} = \mu^{+} \frac{E}{p}$$

$$E$$
(3.1)

$$v^- = \mu^- \frac{E}{p} \tag{3.2}$$

添字の+、-はそれぞれイオンと電子を示している。 μ は易動度 (m²·atm/V·s)、E = (V'/d) は極板間にかか る電場の強さ (V/m)、p はガス圧 (atm) である。 δt 秒後には電子は $v^-\delta t$ だけ正極板に向かって移動し、イオン は $v^+\delta t$ だけ負極板に向かって移動する。 δt 秒後にイオンチェンバーにかかっている電圧を V' とすると、コ ンデンサーが持っていた静電エネルギー が変化するのだから ($CV^2/2 \rightarrow CV'^2/2$)がこの差分がイオン対が電 場中における移動によって得られるエネルギーに等しい。つまりエネルギー保存則より、

$$\frac{1}{2}CV_0^2 - \frac{1}{2}CV'^2 = n_0 e E v^+ \delta t + n_0 e E v^- \delta t$$
$$\frac{1}{2}C(V_0 + V')(V_0 - V') = n_0 e \left(\frac{V'}{d}\right)(v^+ + v^-)\delta t$$
(3.3)

ここで、 n_0 は荷電粒子が生成したイオン対の数である。抵抗 R は読み出し抵抗であり、これにかかる電圧値(δV とする)が我々の求めたいものである。今、この δV は V_0 に比べ十分に小さい ($V_0 + V' \simeq 2V_0$ 、 $V'/d \simeq V_0/d$)と考えると δV は次式のようになる。

$$\frac{1}{2}C(2V_0)\delta V = n_0 e \left(v^+ + v^-\right) \delta t$$
$$\delta V = \frac{n_0 e}{dC} \left(v^+ + v^-\right) \delta t$$
$$\therefore V = \frac{n_0 e}{dC} \left(v^+ + v^-\right) t \tag{3.4}$$

得られる信号量は荷電粒子によって生成されたガスのイオン対がドリフトすることにより誘起されたもの であり、また式 (3.4) より誘起されるパルス高は時間に対しリニアな関係となる事がわかる。

電子の易動度はイオンより約 1000 倍大きい事がわかっている。したがってイオン対のうちイオンよりも電子の方が先に極板に到達する。このときの時刻を r とすると、イオン、電子はそれぞれ v⁺r⁻、x の距離だけ移動しており、読み出される信号のパルス高は式 (3.4) より、

$$V = \frac{n_0 e}{dC} (v^+ t^- + x)$$
(3.5)

となる。そしてイオンが極板に到達する時刻 (t = t⁺) におけるパルス高は、

$$V = \frac{n_0 e}{dC} (v^+ t^+ + x)$$
(3.6)

となる。ここで $t^+ = (d - x)/v_+$ であるから、式 (3.6) は

$$V = \frac{n_0 e}{C} \tag{3.7}$$

となる。

 $0 \le t \le t^{-}$ では誘起される信号は電子とイオン (すなわちイオン対) で作られ、 $t^{-} \le t^{+}$ ではイオンのみで作られる。そして $t = t^{+}$ ではパルス高は最大値 (式 (3.7)) に達する。

さて、図 3.6の回路の構成は直列 RC 回路となっている。そのため実際観測される波形は式 (3.4)の直線的 な立ち上がりと時定数 τ (=*RC*)の指数関数的な立ち下がり (e^{-1/r})の積で表される。この抵抗値 R と電気容量 C を調節することで、読み出したいシグナルを選ぶ事が可能である。すなわち、

- *t*⁺ ≫ *τ* ≫ *t*⁻: 電子由来の信号の取り出し
- *τ* ≫ *t*⁺: 電子及びイオン由来の信号の取り出し

となる。

後でも述べるが、現在 T2K 実験で使用しているイオンチェンバーの読み出しには 65 MHz の FlashADC を 用いている。そして、読み出しはこの FlashADC の時定数 (52.8 ns) でほとんど決まっている。電子のドリフ ト速度を計算すると ~ 10⁶ m/s、イオンでは ~ 10³ m/s であり、イオンチェンバーの極板間隔が 3 mm である から、それぞれ $t \sim 3$ ns、 $t \sim 3 \mu$ s である。T2K 実験における陽子ビームのバンチ間隔は 581 ns なので、こ のように電子由来の信号を読むことにより、バンチごとの測定が可能である。

イオンチェンバーの構成

イオンチェンバーは7つのアレイで構成されており、一つ一つのアレイには7つのセンサーが25 cm 間隔 で設置されている。それぞれのセンサーは電圧をかけるための電極プレート(図 3.7 (左))とシグナル電極プ レート(図 3.7 (右))の2枚の電極で構成されており、スペーサの間隔は3 mm である。それぞれの電極の大 きさは100×100×1 mm³であるが、一様電場部分のシグナルのみを取り出すため、四方を接地し、有効面 積を75×75 mm²としている。スペーサ及び外部に露出する導体を覆っている不導体には放射線耐性の強い PEEK 樹脂を用いている。

使用ガス

表 3.1 にもあるが、使用ガスには 2 種類あり、T2K ビーム強度に応じて変えていく。ビーム強度が低い (\leq 150kW) 段階では Ar+N₂(2%) の混合ガスを用い、強度が高い (\geq 150kW) 段階では He+N₂(1%) の混合ガ スを用いる。N₂ を混合させるのは 2 つの理由がある。

- 1. 信号読み出しを速くする。
- 2. 信号量の変動を防ぐ





図 3.7: センサーとして使用している電極プレート。左図が電圧をかけるための電極プレートで右図はシグナ ル用電極プレートである。75×75 mm²の部分を一様電場部分を有感領域にしている。

である。

1. クエンチャーと呼ばれる自由度の高い、重い分子を混ぜることで、電子の熱運動が分子の回転エネルギー などに分け与えられ、結果としてドリフト速度を速くすることができる。

2.2 種類のガスの混合の場合、ガスの種類と混合の割合によって次の過程が起こる。2 つのガスを X,Y とし、Y 分子の準安定励起準位が X 分子の電離エネルギーよりも高くなると、Y*(準安定励起準位に励起された Y 分子)が中性の X 分子と衝突すると、

$$Y * + X \to Y + X^{-} + e \tag{3.8}$$

となり X 分子が電離する。この効果は Penning 効果と呼ばれ、オランダの物理学者 F.M.Penning により発見された。また、これによりイオン対が増大される現象を Jesse 効果と呼ぶ。図 3.8 は He 中に混合した Ar と N_2 の量を変化したときに電離量がどう変化していくかを示したものである。これを見ると、混合ガスの少しの変動で電離量は多大に変化しているのがわかる。(2つのデータで違う結果を示しているが、Jesse の測定結果(1955) は横軸が正しくないという指摘がある。) 我々は意図的にこの混合ガス (N_2)を一定以上混入することで電離量の変動を防ぎ、これにより信号量の変動を防いでいる。そして、過去のビームテスト [6,7] の結果から、 N_2 を Ar に 2%、He に 1%を混入することにしている。

強度に応じてガスを変えるのは次の理由による。標準状態 STP (20 °C、1 atm) における He と Ar のガス としての性質を表 3.2 にまとめている。最小電離損失と W 値 (1 イオン対を生成するのに必要な平均エネル ギー)を用いる事で、標準状態で MIP がガス中で作る単位長さ (cm) 当たりのイオン対がわかる。計算すると Ar で 95.6 ion pair/cm⁻¹、He で 7.80 ion pair/cm⁻¹ である。つまり、Ar は He に比べ 10 倍以上の信号量を得 ることができる。ミューオンモニターに到達する μ 粒子は運動量で 5 GeV/c 以上のため、MIP ではないが図 3.9 を見ると、5 GeV/c 以上における電離損失は、どの物質中においてもほぼ MIP と等しいと考えても差し支 えない。ビーム強度が低い段階では Ar に 2%を加えたものを使用するが、150 kW を超えた時は電子とイオ ンの再結合による信号量の飽和が起きてしまうと予想される。この時におよそ Ar の 1/10 の信号量である He (+1% N₂) に切り替える予定である。



図 3.8: He ガスに不純物として Ar か N₂ を加えたときの電離量の変化

表 3.2: STP における Ar 及び He のガスの MIP に対する振る舞い

ガス	Ar	He
原子番号	18	2
質量数	39.948	4.003
最小電離損失 (keV/cm)	2.525	0.322
W值(eV)	26.4	41.3



図 3.9: 物質中における μ 粒子、
 π 中間子、及び陽子のエネルギー損失

温度、圧力及び酸素濃度の制御

温度、圧力が変動するとガスの密度も変動する。すると荷電粒子によって生成されるイオン対の量までも 変動してしまい、これは信号の変動につながる。密度は気体の状態方程式で表すと,

$$n = \frac{PV}{RT}$$
(3.9)

P、V、R、及びTはそれぞれ圧力、体積、気体定数、温度である。信号量の変動を3%以内に抑えるために は、多くとも圧力、温度はそれぞれ2%以内の変動に抑えなくてはいけない。またガス中に酸素が混入してい るとドリフト中の電子は容易に酸素と吸着し、その結果信号量が減少する。定量的には酸素混入が100 ppm で1%の信号量減少が確認されている[8]。

図 3.10 にイオンチェンバーのためのガス系統を示す。ガスは Hut と呼ばれるコントロールルーム (図 3.10 左上) にあるガスボンベ (最大充填圧:11.8 MPa) から減圧弁によって絶対圧で 0.2 MPa まで減圧され、そして ミューオンモニターを通り最下流にあるスタック (図 3.10 右上) へと流れ出る。ガス圧は 5 つの PT (圧力計) によって監視している。最下流にある PT は Solenoid control valve と呼ばれる電磁弁とつながっており、こ れは圧力の変化に応じて弁を調節するもので、これにより絶対圧で 130±0.2 kPa (0.17%の変動) に保たれてい る。またチェンバー内の温度は 3 つの PRT (白金抵抗温度計) によって監視している。温度はミューオンモニ ター架台に設置しているヒーターにより、実験中はチェンバー内の温度が 34.0 °C に保つよう調節している。現在はこれが 0.5 °C (0.14%) 程度の変動に抑えられている。

酸素濃度は図 3.10 にある Oxygen analyzer (酸素濃度計) によって監視している。この値はガス流量を 100 cc/min に調節することで、現在は 10 ppm 以下に抑えられている。

これらは、各モニターから出力される電気信号 (電圧値または電流値) をコントロールルーム内にあるデータ ロガー によって物理量に変換することで、読み出している。読み出された物理量は IOC (Input Output Controller) と呼ばれるデータベースに記録される。図 3.11 は温度、圧力、酸素濃度等の値を IOC から呼び出し、表示し たものである。これはスローモニター (Slow な読み出しのため) と呼ばれていて、異常があると、各読み出 し値の横にある緑色のボックスが赤色になる。

3.2.2 シリコン PIN フォトダイオード

ミューオンモニターのもう一つの検出器として、我々は半導体検出器である、浜松ホトニクス製 S3590-08 のシリコン PIN フォトダイオード (図 3.12) を用いている。表 3.3 にこの検出器の特徴を示した。ミューオン モニターではこの検出器に対し、逆電圧 80 V を印加して使用している。

半導体検出器の動作原理

半導体検出器の動作原理に関しても、既に述べた Ionization chamber のそれとほとんど一緒である。尚、半 導体検出器の特性については付録 A で述べている。唯一異なる点はガスか結晶かの違いであり、半導体検出 器の場合、イオン対ではなくキャリア対(電子とホールのペア)が移動することで生じる誘導電流をシグナル



図 3.10: イオンチェンバーのガス系統



図 3.11: ミューオンモニター用のスローモニター


🗵 3.12: S3590-08

表 3.3: \$3590-08 の特徴

有効面積	$10 \times 10 \text{ mm}^2$
空乏層厚さ	300 µm
最大印加電圧	100 V

として用いる。また半導体検出器の場合はそのキャリア対を生成するためのエネルギー(以下、電離エネル ギーと呼ぶ)がガスの電離エネルギーよりも10倍ほど低く、より大きいシグナルを得る事ができる。

3.2.3 エレクトロニクス

ケーブリング

既に述べたとおり、ミューオンモニターは 100 Gy/year と放射線の高い環境下にある。したがって検出器周 りのケーブルも放射線耐性の強いポリイミドケーブルを用いている。このケーブルは検出器から 10 m ほど 延びており、そこからタッチパネルを通して、70 m ほどある信号ケーブル及び HV ケーブルにつながってい る (図 3.4 を参照)。信号ケーブルは 5D-FB 規格のものを、HV ケーブルは RG-174 規格のものをそれぞれ使 用していて、どちらも難燃性であるノンハロゲンケーブルである。

電圧印加回路

電圧印加回路は 2010 年の夏のシャットダウン期間中にアップグレードがなされた。詳しくは第5章を参照 されたい。

読み出し回路

我々はデータを収集システムについて高エネルギー加速器研究機構(KEK)で開発された COPPER を導入し ている。COPPER はデータ収集システムにおけるパイプラインの標準読み出しモジュールである。COPPER は VME9U クレートのスロットに挿入され、独自に CPU を搭載し、内蔵のイーサーネットポートを通じて外 部とのデータ通信を行う。小型の FINESSE カードを使用することで目的に応じ様々な機能(ADC、TDC等) を選択できる。ミューオンモニターでは FINESSE カードとして 65MHz FlashADC を最大数である 4 枚を挿 入して使用している。FlashADC を用いる事で、バンチごとの波形の情報を知る事ができる。表 3.4 にこの FINESSE FlashADC の仕様をまとめる。

表 3.4: ミューオンモニターに使用している FINNESSE FlashADC の仕様

最大サンプリングレート	65MHz
入力レンジ	±1 V (内部ゲイン×1)、±200 mV (内部ゲイン×5)
ダイナミックレンジ	12 bit
チャンネル数/ボード	8 ch
時定数	52.8 ns

読み出し回路を図 3.13 に載せた。加速器から来たビームトリガーは光ケーブルによって伝送される。これ を Transceiver によって NIM 信号に変換し、FAN IN/OUT(1) によって片方は Digital Gate&Delay Generator で ゲート幅を拡げ、またミューオンビームがミューオンモニターまで到達する TOF も考慮し、信号を遅延させ ている。そして別の FAN IN/OUT(2) によって COPPER の全使用チャンネルにこのゲート信号を配っている。 FAN IN/OUT(1) もう片方の出力信号は Gate&Delay Generator でゲート始まりより 150 ns 以上遅延させ、

COPPER に PC ヘデータ処理するための合図 (GP-IO) を送っている。 サンプリングには Clock Generator によって 65 MHz のパルス信号を用いている。これは FAN IN/OUT (3)

によって COPPER の全使用チャンネルに配っている。

シリコン PIN フォトダイオードからの信号は Attenuator によって減衰率 0 dB、-15dB、または 30-dB で減 衰され、ゲイン ×1 の Flash ADC に入力される。減衰率はビーム強度に応じて変えていく。この Attenuator についても 2010 年の夏のシャットダウンで一新した。5 章にて詳しく述べる。

一方イオンチェンバーからの信号は直接ゲイン ×5の FlashADC に入力される。

3.3 キャリブレーション

3.3.1 エレクトロニクスキャリブレーション

FlashADC で読み込まれた信号は最終的には電荷の値に換算する。この換算係数はエレクトロニクスキャ リブレーションを行って求めている。以下にこのキャリブレーション方法を述べる。

エレクトロニクスキャリブレーションは,



図 3.13: 読み出し回路図

- ケーブル伝送による信号量の減衰
- 読み出し回路 (attenuator·FlashADC) による信号量の変化

を考慮して行い、最終的に積分 ADC カウントから電荷の値へと換算する。セットアップを図 3.14 に載せた。 以下に信号読み出しまでの流れを示す。

- まず、ミューオンモニターが設置している NU3 の地下から最大出力 600 pC の QT ジェネレータ (Philips 7120)を用いて信号を送る。この時送られる信号は 2 種類あり、1 つは FlashADC の波形読み込み用の 信号で、もう 1 つは NIM 信号である。また、QT ジェネレータからパッチパネル間の波形読み込み用 の信号は実際のデータ取得に似せるため、Polyimide ケーブルを用いて伝送する。
- 2. QT ジェネレータからの信号はパッチパネルにつなぐ。このパッチパネルは検出器数以上のチャンネル を有している。信号はパッチパネル間の67mのシグナルケーブルを介してコントロールルームにある 読み出し回路へと送られる。Polyimideで伝送した波形読み込み用の信号は実際に使用しているチャン ネルにつなぎ、NIM 信号は未使用のチャンネルにつないでいる。
- パッチパネル間を介して、信号は読み出し回路へ入力される。パッチパネルでシリコン PIN フォトダイ オードのチャンネルから伝送した波形読み込み用信号は Attenuator (0、15、30 dB)を介し、ゲイン×1 の FlashADC で読み込む。一方イオンチェンバーのチャンネルからの波形読み込み用信号は Attenuator には入れず、直接ゲイン×1 の FlashADC で読み込む。これは 3.2.3 章で述べたようなデータ取得のセッ

トアップに合わせるために行っている。NIM 信号は途中 Fan IN/OUT で分割し、FlashADC のゲート用 と GP-IP 用に用いる。

既知である QT ジェネレータの出力信号の大きさを変えていき、そのときの積分 ADC カウントを求めるこ とで、最終的に換算係数を求めている。図 3.15 は FlashADC で得た QT ジェネレータからの電荷 600 pC の 時の波形 (attenuator:15 dB) である。これの波形積分をとり、積分 ADC カウントを求める。各出力電荷に対 し、800 イベント分の積分 ADC カウントを求め、その中心値と統計誤差を求める。そして、図 3.16 のよう に得られた積分 ADC カウントの中心値 (誤差棒:統計誤差) と出力電荷の関係をプロットし、1 次関数を求め る。このフィット係数の逆数を換算係数と定義する。この作業は実際に使用する検出器の全チャンネルに対 して行っている。このエレクトトロニクスキャリブレーションは物理ラン開始前に行っていて、全チャンネ ルの換算係数は 1%の精度で求められている。



図 3.14: エレクトロニクスキャリブレーションのセットアップ

3.3.2 ビームを使った検出器キャリブレーション

シリコン PIN フォトダイオーとイオンチェンバーにはそれぞれ駆動架台が備え付けており、相対キャリブ レーションを行うことで、検出器間の個体差のキャリブレーションを行っている。



図 3.16: 積分 ADC カウントと出力電荷の関係。1 次関

図 3.15: FlashADC で読み込んだ QT ジェネレータから 数でフィットし、そのフィット係数を換算係数と定義の波形。ここでは出力電荷 600 pC の信号を attenuator する。 (15 dB) に通した波形を示している。

シリコン PIN フォトダイオードの場合、プロファイル再構成に使用している 49 ch とは別にそこから 23 cm 下流に相対キャリブレーション用のシリコン PIN フォトダイオードを 1 ch 設置している。このチャンネル は駆動架台によって 49 ch 全ての位置に動くことができ (図 3.3.2)、これにより全チャンネルの相対キャリブ レーションが可能となる。キャリブレーション方法は次の通りである。

まず、相対キャリブレーション用のチャンネルを各チャンネルの裏側に動かし、そこで 10 スピルのビーム を受ける。図 3.18 はこの操作によって得られた、各チャンネルの信号と、相対キャリブレーション用チャン ネルとの信号比、図中赤い線はこれら信号比の平均値で、次の式で表せるものである。

< Signal ratio >=
$$\frac{\sum_{i=1}^{7} \sum_{j=1}^{7} \{Q(i, j) / refQ(i, j)\}}{49}$$
 (3.10)

ここで、i、j はチャンネルの位置を表している。*refQ(i, j*) は相対キャリブレーション用チャンネルが位置(i,j) に来た時の信号を示す。式 (3.10) を用いて以下のようにして各チャンネルの相対ゲインを求める。

Relateve gain(x, y) =
$$\frac{Q(x, y)/refQ(i, j)}{<\text{Signal ratio}>} \quad (1 \le x \le 7, \ 1 \le y \le 7)$$
(3.11)

各チャンネルで得られた信号に対し、この相対ゲインの逆数をかけることで、相対キャリブレーションを する。これにより、現在はチャンネル間の信号の個体差が 0.1%以内に抑えられている。

一方でイオンチェンバーの場合は7つのトレイが1つの駆動架台に設置されており、49 ch 全てを上下左右 25 cm に動かす事で相対キャリブレーションを行っている。しかし、シリコン PIN フォトダイオードの時と 違い、49 チャンネル全ての位置に動かせるわけではなく、計9カ所の位置にしか動かすことができない (図 3.19)。したがって次のように相対ゲインを求めている。



図 3.17: シリコン PIN フォトダイオードの相対キャリブレーション



図 3.18: 各チャンネルの相対キャリブレーション用チャンネルとの信号比。赤い線はこの信号比の平均値を 表している。

図 3.19 のように 9 カ所動かし、シリコン PIN フォトダイオードと同様、10 スピルのビームを受ける。元々位置 (x,y) にいたチャンネルが位置 (X,Y) に来たときに得られる、10 スピル分の収集電荷量の平均値 Q(x, y, dx, dy)、 及び統計誤差 (RMS/ $\sqrt{10}$)を $\delta Q(x, y, dx, dy)$ とする。ただし、dx = X - x、dy = Y - yである。この時、 $\Delta \chi^2(X, Y)$ を次のように定義する。

$$\Delta \chi^{2}(X,Y) = \sum_{x+dx=X} \sum_{y+dy=Y} \left(\frac{Q(x,y,dx,dy)R(x,y) - M(X,Y)}{\delta Q(x,y,dx,dy)} \right)^{2}$$
(3.12)

ここで、R(x, y)は求めるべき各チャンネルの相対ゲインである。また、M(X, Y)は加重平均で、次のように定義する。

$$M(X,Y) = \frac{\sum_{x+dx=X} \sum_{y+dy=Y} \delta Q(x,y,dx,dy)^{-2} Q(x,y,dx,dy) R(x,y)}{\sum_{x+dx=X} \sum_{y+dy=Y} \delta Q(x,y,dx,dy)^{-2}}$$
(3.13)

全ての位置 (X,Y) で $\Delta \chi^2(X,Y)$ を求めたら、これの総和 χ^2 を求める。

$$\chi^2 = \sum_X \sum_Y \Delta \chi^2(X, Y)$$
(3.14)

こうして求めた χ^2 は相対ゲインをパラメータとしている。相対ゲイン自身は 49 個のパラメータであるが、 その内の1つは1(参照用)としているので、結果的に χ^2 は 48 個のパラメータをもつ。後は、Reduced χ^2 を 最小とするような 48 個のパラメータ (相対ゲイン)を、最小アルゴリズム (ROOT [9] の Minuit2)を用いて算 出する。図 3.20 はこの手法を用いて得られた各チャンネルの相対ゲインである。この相対ゲインを用いて、 電荷量をキャリブレーションし、個体差をなくしている。イオンチェンバーについても、シリコン PIN フォ トダイオードと同様、現在個体差を 0.1%程度に抑える事が出来ている。



図 3.19: イオンチェンバーの相対キャリブレーション。上下左右の計9箇所に動かして行う。



図 3.20: 相対キャリブレーションで得られたイオンチェンバーの相対ゲイン

第4章 T2K ニュートリノモニター INGRID Shoulder Module

T2K ニュートリノモニター INGRID はニュートリノを鉄標的と反応させて、それによって生じた荷電粒子 のトラック数を測定することでプロファイルを再構築し、ニュートリノビームの方向と強度を測定する検出 器である。この INGRID と同じ構造である INGRID Shoulder Module は 2010 年夏に製作、そして秋にインス トールされた検出器である。この章では主に INGRID Shoulder Module の製作過程、その評価試験について 述べる。

4.1 T2Kニュートリノモニター

4.1.1 INGRID

INGRID は炭素標的から 280 m 下流にある前置検出器ホール (図 2.10 内に設置されている。ミューオンモ ニターと同じく on-axis 上に置かれた検出器であり、ニュートリノビームのプロファイルを測定し、ニュート リノビーム方向を測定する。また検出器内で反応したニュートリノイベントのレートを測定し、ニュートリ ノビームの強度も測定する。

INGRID は、構造が全く同一のモジュールを垂直方向に7台、水平方向に7台配置し(図 4.1)、ビーム中心 の±5 m の領域を覆っている。各モジュールは鉄プレートと、プラスチックシンチレータで構成たトラッキ ングプレーンのサンドイッチ構造で構成されている(図 4.2)。鉄プレートは1つのモジュールに対し9枚使用 されていて、鉄プレート1つの体積は124×124×6.5 cm³である。これら鉄プレーンの総質量はモジュール あたり7.1 ton にもなる。一方トラッキングプレーンは大きさが1.0×5.0×120.3 cm³の1本のバーを垂直方 向に24本並べたものと、水平方向に24本並べた計48本のシンチレータバーによって構成されており、使用 しているシンチレーターバーは合計で8448本にもなる。またビーム上流側から数えて10枚目と11枚目ト ラッキングプレーンの間には鉄プレートは挟まっていない。各モジュールに対し、VETO用のシンチレータ プレーンが左右側面、上部及び下部を囲っている。VETO用のシンチレータプレーンの大きさは2種類あり、 下部のプレーンは1.0×5.0×111.9 cm³のシンチレータバーを、その他のプレーンでは1.0×5.0×129.9 cm³ のシンチレータバーをどちらも22本使用している。また隣り合うモジュール間にある VETO プレーンに対 しては同じものを共有している。

各シンチレータには波長変換ファイバー (シンチレータと同じ長さに揃えたもの)を挿入するための直径 3 mm 程の小さな穴が開けられている。シンチレータ側面には酸化チタンベースの反射材を塗布し、シンチ レーション光を検出する光センサーの逆側の面にも同様の反射材を塗布する。シンチレーション光はシンチ レータに挿入された波長変換ファイバーによって波長を変換し、MPPC と呼ばれる光センサーによって読み 出しを行っている。





図 4.1: on-axis 検出器 INGRID。計 14 台のモジュール が縦・横方向に 7 台ずつ並べられている。両脇にある 2 台のモジュールは今年インストールされた INGRID shoulder module (後述)。

図 4.2: INGRID を構成している 1 モジュール。鉄 (青 く塗装されている) とシンチレータのサンドイッチ構 造となっている (左)。さらに左右側面と上下に VETO プレーンが設置される (右)。

MPPC

MPPC は Multi-Pixel Photon Counter の略称であり、浜松ホトニクスによって製造された半導体 (Silicon) 光 検出器である (図 4.3)。有感面積 1.3 mm² の受光面を持ち、これは一辺が 50 μ m の 667 個の APD (Avalanche PhotoDiode) ピクセルから構成されている。MPPC を用いる時はこれらはガイガーモードで動作させるため、 印加電圧をおよそ 70 V まで上げる。また、APD ピクセルがガイガーモードとなった時の電圧はブレイクダ ウン電圧と呼ばれる。尚ガイガーモードで動作させた時の APD1 ピクセル当たりの出力電荷 Q は次のように 定義される。

$$Q = C(V - V_{bd})$$
$$\equiv C\Delta V_{over}$$
(4.1)

Trigger mode	Beam trigger		
Purpose	MPPC のゲイン測定	宇宙線試験による光量・検出効率の測定	ビームデータ取得

ここで *C、V、*及び *V_{bd}* はそれぞれ MPPC の電気容量、印加電圧、そしてブレイクダウン電圧である。また ΔV_{over} は印加電圧とブレイクダウン電圧の差分である。通常 MPPC を動作させる際は、ブレイクダウン電 圧よりも 1.0-1.5V 程高い電圧値を印加する。また電気容量の値は ~100 fF 程度なので、式 (4.1) で得られた出

圧よりも 1.0-1.5V 程高い電圧値を印加する。また電気容量の値は ~100 fF 程度なので、式 (4.1) で得られた出 力電荷を素電荷で割る事で MPPC が持つゲインを得られる。計算するとおよそ 6-10×10⁵/pixel 程である。ま たブレイクダウン電圧は温度に依存する事が知られており、1 °C 上昇するごとに 50 mV 程上がる事が分かっ ている。

MPPC は特に光子数の計測に優れており、図 4.4 のように光子数ごとの ADC 分布がはっきりと見る事がで きる。しかし、MPPC はノイズレートが大きく、価電子帯にある電子が簡単に伝導帯へと熱励起してキャリ ア対を作ってアバランシェを起こすため、光電面に光子が来なくても1光子または2光子のピークが見えて しまう。MPPC の基礎特性について、付録 B に記した。





図 4.3: MPPC (浜松ホトニクス社製)。1 mm² 程の受光 図 4.4: MPPC で得られる光量分布。光子計測能力に 面 (中央の黒い四角部分)をもつ。 優れており、1 光子と 2 光子のピークが奇麗に見えて いる。

データ取得システム

INGRID では読み出し回路に TFB と呼ばれるフロントエンドボードとバックエンドボードを用いている。 フロントエンドボートについては以下の役割を持つ。

- トラッキングプレーン1層当たり1枚使用。
- MPPC からの信号を AD 変換、及び TD 変換する。

• MPPC への印加電圧の調整を行う。

一方バックエンドボードは3種類から成っていて、それぞれ次のような役割を持つ。

- RMM (Readout Merger Module): TFB からのデータを読み出す
- CTM (Cosmic Trigger Module): TFB からのトリガーシグナルを受け Cosmic trigger を作り、MCM に 送る。
- MCM (Master Clock Module): Cosmic trigger もしくは Beam trigger を受け、RMM に読み出し開始のシ グナルを送る。

ここで、トリガーモードについては、1. Periodic trigger 2. Cosmic trigger 3. Beam trigger の3種類のトリ ガーが用意されていて、それぞれの用途は表 4.1 の通りである。

MPPCの出力信号はまず、TFBでAD変換(波高情報)及び、TD変換(時間情報)され、次いでバックエンドボードへ送られる。外部から与えられるゲート時間の間に MPPC から出力された信号がデジタル変換されて読み出されるが、現在のファームウェアーではゲートの最後 50 ns には TDC データが取れない。また、ゲート終了後、100 ns は不感時間になっている (この間に読み出しボード上でリセットが行われる)。ゲート時間は 10 ns の単位で 100 - 2000 ns の範囲内で調整できる。1回のゲートとその後のリセットをまとめてサイクルと呼ぶ。INGRID の読み出しシステムは各 MPPC の 23 サイクル分のデータを各フロントエンドホードのバッファーに保持しており、外部から 1回のデータ 読み出し命令を与えると、23 サイクル分のデータが出力される。こうして、各サイクルに ADC 及び TDC の情報が詰められる。

4.1.2 INGRID shoulder module

INGRID shoulder module は 2010 年の夏に製作、秋に前置検出器ホール内にインストールされた計 2 台の 検出器である。INGRID は計 14 台あり、モジュール番号として 0 から 13 まで順次つけられている。これに ならい、shoulder module はモジュール番号として 14,15 とつけた。図 4.1 にもあるように、水平方向に並ん だモジュールの両肩の位置にあることから INGRID shoulder module と名付けられた。モジュールの構成は INGRID に使用しているものと全く同じである。鉄で出来た足場の上にモジュールを置き (図 4.5(a))、それを 図 4.1 のように両脇に置く事で、ニュートリノビームのプロファイルの非軸対称性を測定することを目的とし て設置された。鉄で出来た足場があるため水平方向に置かれた INGRID モジュールに対し、およそ 2.5 m ほ ど高く、また鉛直方向に対して左右 3.1 m (右: module14、左: module15)の位置に設置されている。図 4.5(b) は実際の INGRID shoulder module (インストール後)の 2 台ある内の 1 台 (module14)の写真である。

4.2 INGRID shoulder module の製作

INGRID shoulder module に使用されるトラッキングシンチレータプレーン及び VETO 用シンチレータプ レーンは 2009 年の INGRID インストール時には既に製作済みであった。しかし、製作してから月日が経過し ていること、また保管場所の移動等により、MPPC から TFB 間をつないでいる信号ケーブルの切断箇所が確



図 4.5: (a) INGRID shoulder module の構成。INGRID で使用されるモジュールと同一のモジュールを使用し、 さらに高さ約 2.5 m の鉄の構造体の上に載せる。(b) INGRID shoulder module (module14) の実際の写真。

認された。したがって shoulder module の製作にあたり、まずは MPPC のノイズを測定することによるケーブ ルの確認、修復を行った。またこのノイズ測定は先に行った MPPC の大量測定 [10] で得られたノイズレート 及びゲインの再測定も兼ねている。ケーブルを修復した後に宇宙線を用いた光量の測定を行い、MPPC ない しファイバーの不良により光量が低いチャンネルがあった場合、それらの交換をし、再度光量を測定するこ とで、全チャンネルに対し十分な光量を会得できるようにした。これらの作業を終えた後、shoulder module の組み立て作業を行い、前置検出器ホールへのインストールを行った。表 4.2 には shoulder module のインス トールまでの流れを載せた。

表 4.2: INGRID shoulder module インストールまでの流れ

2010年	インストールまでの流れ
9月初旬-10月初旬	MPPC ノイズ試験によるケーブル修復及び宇宙線を用いた光量試験
10月下旬-10月中旬	shoulder module の組み立て作業
10月中旬	前置検出器ホールへの shoulder module のインストール

4.2.1 MPPC ノイズ評価

ここでは9月初旬から10月下旬にかけて行ったケーブル切断箇所確認のためのノイズ試験について述べる。テスト場所及び組み立て作業はJ-PARC内のHENDEL棟(出来れば図を載せる)にある大実験室で行った。各モジュールに設置されるトラッキングプレーンは計11台であり、そのチャンネル数は528ある。モジュールは計2台あるため測定すべきトラッキングプレーン数は22台あるため、1台ずつ試験を行うのは膨大な時間がかかる。それで、図4.6のようにトラッキングプレーンを4台、向きをそろえて重ねて試験を行った。ここでは全MPPCチャンネルのケーブル損傷のチェックと、ノイズレートの測定結果について述べる。

ケーブル損傷のチェック

まずケーブルの損傷があるかどうかチェックするため、全 MPPC のノイズによる ADC 分布を確認した。これにより、MPPC の1 p.e、2 p.e. の信号が見えない場合、そのチャンネルに対してはケーブルに損傷があるかどうか確認する。他にも MPPC とケーブルの接触不良、また TFB とケーブルの接触不良によって1 p.e、2 p.e. の信号が見えない可能性もある。こういった事も確認していく。

実験を行った HENDEL 棟では空調施設がないため、試験を行った 9 月から 10 月にかけては温度は 20-30 °C とめまぐるしく変化した。先にも述べた通り、MPPC のブレイクダウン電圧は温度に依存する。この試験は 先に行った MPPC 大量測定の結果との比較も兼ねているため、常に温度をチェックし、MPPC 大量測定時の ΔV (=1.5 V) に合わせるためにも印加電圧を調整する必要があった。トリガーモードは Periodic trigger を使用 した。

図 4.7 は測定時に得られた MPPC からのノイズ分布 (ADC 分布) である。尚 ΔV = 1.5 V としている。図 4.7(a) は 1 p.e.、2 p.e. の信号が見えているが、(b) はそれが見えていない。こういったチャンネルについては、

ケーブルの損傷を確認した後、MPPC 及び TFB に接続されている信号ケーブルを外し、新たな信号ケーブル を接続することで修復を試みた。結果、今回見つかったデッドチャンネルの原因は全てケーブル損傷による もので、1056 チャンネルのうち 8 チャンネルあった。



図 4.6: MPPC ノイズ評価におけるセットアップ。写真のように 4 枚のトラッキングプレーンを同じ向きに揃え、重ねて同時に試験を行った。



図 4.7: MPPC のノイズ分布。(a) は正常なチャンネルで 1 p.e.、2 p.e. の信号が見えている。一方、(b) は 1 p.e.、 2 p.e. の信号が見えていない。これはケーブル損傷が原因である。

VETO プレーンはモジュール1台につき4枚あり、計8枚測定する必要があった。またトラッキングプレー ンと違い、シンチレータ層がXY方向の2層でなく、単一方向の1層であるため、module14、と module15 に 使用される全て(8枚)の VETO プレーンを重ね、一度にテストを行った。全てのチャンネルについて MPPC のノイズ ADC 分布をチェックした結果、ケーブル損傷はない事を確認した。

ノイズレート測定

ケーブルの修復を終えた後は再び $\Delta V = 1.5 V$ に設定して MPPC ノイズレートの測定を行い、過去の大量測定 [10] で既に得られた値との比較を行った。図 4.8 は module14 に使用されるトラッキングプレーンのノイズレートであり、モジュール 1 台分 528 チャンネルを (a) 192 チャンネル (プレーン 4 層分)、(b) 192 チャンネル (プレーン 4 層分)、(c) 144 チャンネル (プレーン 3 層分) に分けて載せたものである。横軸 0、48、96、144 で引かれている直線はプレーンの境界線を表している。図中黒いプロットはデータシートに記載されている値であり、赤いプロットが今回測定した値を表している。黒いプロットの中で 0 を示しているものがあるが、これは以前の測定がなく、データシートに元々記載されていないためである。module15 に関して、同様の図 4.9 を載せた。図 4.8 にしても図 4.9 にしても赤と黒のプロットではプレーンごとに系統的な違いが見られる。これは以下の理由によるものと考えられる。

ブレイクダウン電圧の温度依存性に関しては既にこの実験では補正済みである。しかし、温度が上昇する ことにより、MPPC (silicon)の価電子帯にいる電子は優に伝導帯へと熱励起してしまうため、ノイズレート も上昇してしまう。単位体積あたりにノイズが生じる確率は次の式で表される。

Noise rate
$$\propto T^{2/3} \exp(-\frac{E_g}{2k_b T})$$
 (4.2)

例えば図 4.10(a) は module14 に使用されているプレーン (図 4.8 の (a) の始めの 48 チャンネル) について、 今回測定したノイズレートとデータシートのそれと比べたものである。誤差棒であるが、黒いプロット (デー タシート) に対してはノイズレートを算出する際に用いるペデスタル (0 p.e.) 部分のイベント数のばらつきと 恒温槽の温度ばらつきを考慮している。また、赤いプロット (今回の測定) の誤差 はペデスタル部分のイベン ト数のばらつきと、電圧のリップル (30mV) を考慮して与えたものである。今回の測定においては温度は計 測していたが、1 回のノイズ試験に要する時間が 10 秒以内と極めて短かったので温度のばらつきは無視した。 これを見ると個々のチャンネルのばらつき具合は両者で一致しているが、全体的に今回の測定値の方がノイ ズレートが大きい。この原因は、試験を行った HENDEL 棟はこのプレーンを測定時は 27.1 °C、データシー トに記載されている値は 25 °C と、それぞれ計測時の温度で違いが生じていたためと考えれる。図 4.10(b) は 今回の測定値とデータシートの値の差分を各チャンネルに対してプロットしたものである。同中水色の実線 は温度の違いから予想されるノイズレートの差を式 (4.2) を用いて求めたものである。有意にずれているチャ ンネルがいくつかあるが、基本的に今回の測定値とデータシートの差分は温度の違いから予想されるノイズ レートの差分と説明できる。図 4.10(c) は (b) の各チャンネルにおけるノイズレートの差分の中心値の分布を とったものである。

再確認の意味で行ったトラッキングプレーンの各 MPPC チャンネルのノイズレート測定は個々のチャンネ ルのばらつき具合はデータシートとよく一致していたが、このように温度の違いの効果が如実に現れていた。 各プレーン (全 48 チャンネル) に対しこの効果を確かめたのが図 4.11 である。図中黒い三角は各プレーンに おけるノイズレートの差分の分布 (図 4.10(c)) の中心値、誤差棒はその RMS を示している。一方青い逆三角 は計測時の温度の違いから予想されるノイズレートの差分を示している。多くのプレーンについて、測定さ







図 4.8: module14 に使用される全トラッキングプレーン (48×12 チャンネル)の各チャンネルのノイズレート。 黒いプロットはデータシート (ΔV=1.5 V、温度 25.0°C)によるもの、赤いプロットは今回測定したものを表 す。図中に引かれている実線はトラッキングプレーン (48 チャンネル)の境界線を示したものである。個々の チャンネルのばらつき具合は両者で一致している。以前の測定が無いため、データシートでノイズレートが 記載されていないチャンネルもあり、0 にジャンプしている黒いプロットがそれである。



図 4.9: module15 に使用される全トラッキングプレーン (48×11 チャンネル)の各チャンネルのノイズレート。 黒いプロットはデータシート (ΔV=1.5 V、温度 25.0°C)によるもの、赤いプロットは今回測定したものを表 す。図中に引かれている実線はトラッキングプレーン (48 チャンネル)の境界線を示したものである。個々の チャンネルのばらつき具合は両者で一致している。以前の測定が無いため、データシートでノイズレートが 記載されていないチャンネルもあり、0 にジャンプしている黒いプロットがそれである。

れたノイズレートの違いは温度の違いであることが理解できる。しかし、中には不一致の点が見られた。こ れは測定時、温度計は常にトラッキングプレーンの外に置かれていたが、MPPC はトラッキングプレーンの 構造体の中に入れていたため、実際に MPPC の温度をちゃんと計測できていなかった可能性がある。そのた め、ノイズレートの違いを正しく見積もれていなかったと考えている。

図 4.12 は VETO プレーンの各チャンネルにおけるノイズレートを表したもので、黒いプロットはデータ シートに記載されている値、赤いプロットは今回測定したものである。横軸 0、22、44、66 で引かれている 直線は VETO プレーン (全 22 チャンネル)の境界を示したものである。チャンネルの個々のばらつきはデー タシートと今回の測定で非常に良くあっている事がわかる。若干だがデータシートの値 (黒いプロット)の方 が全体的に測定値を上回っているが、これもやはり計測時の温度 (22.8 °C) とデータシートの場合 (25.0 °C) で違いがあるためと思われる。

4.2.2 宇宙線を用いた光量評価

ここでは MPPC ノイズ評価試験と並行に行われた光量評価について記述する。光量評価ではシンチレータ 内のファイバーの損傷、MPPC の光電面に汚れ、後はシンチレータ内のファイバーと MPPC との接続正しく ないといった、MPPC ノイズ評価ではわからない問題を調べる。この試験を行うことで光量の低いチャンネ ルを見つけ出し、改善をすることが目的である。セットアップは MPPC ノイズ評価試験の時と同様にトラッ キングプレーンに関しては4枚重ねて、また VETO プレーンに関しては8枚重ねて試験を行った。トリガー モードは cosmic trigger を用いている。 $\Delta V = 1.1 V$ に設定した。このトリガーモードにおいて、宇宙線が4枚 のプレーン (Veto プレーンの場合8枚) でヒットがあった場合のみ、トリガーをバックエンドボードから TFB に配り、データを取得するように設定した。

ここで ADC カウントから光量に変換するための手順を述べる。図 4.13(a) は ΔV = 1.1 V における MPPC の ADC 分布をダブルガウス分布でフィットした結果である。これによりペデスタル部分のピークと 1 p.e. の ピークの ADC カウントがフィットパラメータから判明する。そして、このピークの差分を MPPC のゲイン として定義する。したがって ADC カウントから光量に変換する式は次のようになる。

$$Light yields = \frac{ADC counts - ADC count of pedestal peak}{Gain}$$
(4.3)

図 4.13(b) は宇宙線試験で得られた ADC 分布である。これに式 (4.3) の変換式を用いて光量分布にしたの が図 4.13(c) である。宇宙線試験をする際は直前に $\Delta V = 1.1$ V で MPPC のノイズ試験を行い、ゲインを求め ておく必要がある。また MPPC 間でゲインは異なるため、全てのチャンネルについて、この作業は必要であ る。図 4.13(b) で ADC count が 1000 に近いところで山が見えるが、これは MPPC からの出力信号が ADC の 入力レンジ (最大 1024 カウント) を超えたため、線形性が失われこの付近に留まっているためである。



図 4.10: (a) トラッキングプレーン 1 枚あたりの各チャンネルのノイズレート。黒いプロットはデータシート (ΔV=1.5 V、温度 25.0°C) によるもの、赤いプロットは今回測定したものを表す。(b) (a) の赤いプロットと黒 いプロットとの差を各チャンネルについてとったもの。水色の実線は両者の温度の違いから予想されるノイ ズレートの差を表している。(c) (b) のノイズレートの差分の中心値について分布をとったもの。



図 4.11: トラッキングプレーンごとの測定ノイズレート差と温度の違いから予想されるノイズレート差の比較。黒い三角は各プレーンごとに求めたノイズレート差の分布の中心値で、誤差棒はその分布の RMS。青い 逆三角は温度の違いから予想されるノイズレート差である。(a) は module14、(b) は module15 についてそれ ぞれ示した。



図 4.12: 1 モジュール当たりの全 VETO プレーン (22×4 チャンネル) の各チャンネルにおけるノイズレート。 黒いプロットはデータシート (ΔV=1.5 V、温度 25.0°C) によるもの、赤いプロットは今回測定したものを表 す。図中の実線はプレーンの境界線を示している。



図 4.13: (a) MPPC ノイズ分布からのゲインの求め方を示した図。1 光子ピークと0 光子ピークの差分がそれ である。(b) 1 チャンネル当たりの宇宙線の光量分布 (横軸: ADC counts)。(c) 1 チャンネル当たりの宇宙線の 光量分布 (横軸: 光量)。(a) で求めたゲインを用いて ADC カウントから光量に変換させたもの。

このようにして ADC カウントから光量へと換算して得られた宇宙線イベントに対し、さらに以下のイベ ントセレクションを課した。

- 光量が6p.e 以上かどうか これは MPPC ノイズを避けるためと、宇宙線による光量の分布のみを測定するためである。
- ゲートサイクルが14サイクル目かどうか
 宇宙線イベントは14サイクルに記録されるようトリガータイミングを調整してある。
- 注目しているチャンネルの上下のシンチレータでヒットがあるかどうか プレーンは同じ向きに重ねられており、シンチレータは図 4.14 のように並んでいる。この図では 3 層 分のプレーンが描かれている。光量を見たいチャンネル (赤いシンチレータ) と同じ向きの上下のシン チレータ (緑のシンチレータ) で同時にヒットがあった場合、このイベントを用いる。尚一番上(下)の プレーンについては同じ向きの下(上)のシンチレータのヒットのみを要求する。
- データ取得時間は6時間
 限られた時間の中でかつ十分に統計がたまるよう6時間をデータ取得時間とした。



図 4.14: 宇宙線ヒットのセレクション。あるチャンネルの宇宙線による光量分布を見る際は、光量を見たい チャンネル (赤いシンチレータ) と同じ向きの上下のシンチレータ (緑のシンチレータ) で同時にヒットがあっ たイベントを用いる。

これらイベントセレクション後の宇宙線の光量分布は図 4.15(a) となり、宇宙線による光量のピークが見え る。この分布に対し、ランダウ分布とガウス分布の混合分布でフィットを行い (図 4.15(b))、その最頻値を光 量のピークと定義した。

光量の低いチャンネルがあるかどうかのチェックでは、以下のような操作を行った。まず4枚のトラッキン グプレーン (全 192 チャンネル) ごとに全てのチャンネルの光量ピークの分布 (図 4.16(a)) を求める。この分 布に対し、ガウス分布でフィット (図 4.17(b)) をしてその中心値とσをフィットパラメータから引き出す。続 いて図 4.17 のように 4 つのプレーンについてそれぞれ横軸が MPPC チャンネル、縦軸がその光量ピークのプ ロットを作り、光量ピークが先ほどフィットしたガウス分布の 3σの範囲内であれば問題ないと判断し、範囲 の外に漏れたチャンネルについては、念のためファイバーの損傷及び MPPC の光電面の汚れの確認を行った。



図 4.15: (a) 宇宙線セレクションで測定したチャンネルの光量分布。(b) (a) の分布に対しガウス分布とランダ ウ分布の混合分布でフィットしたもの。その最頻値を光量ピークと定義する。



図 4.16: (a) トラッキングプレーン 4 枚の各チャンネルで得られた光量ピークの分布。(b) (a) の分布にガウス 分布でフィットをしたもの。これから中心値とσを求めた。

確認した結果を表4.3 にまとめた。MPPC の光電面に汚れが見つかった1チャンネルについては、MPPC そ のものを交換する事で改善した。また、ファイバーにも MPPC にも何も問題が見られないのに、光量ピーク が~5 p.e と異常に低いチャンネルが1つあり、ファイバーを交換、また MPPC を交換等の対策を講じたが、 改善は見られなかった。詳しい原因は分からないが、おそらく反射材が削れている等、シンチレータそのも のに問題があると考えられる。このチャンネルを含むプレーンについてはニュートリノイベントのトラッキ ング再構成に比較的影響を与えない最下流側に用いる事にした。

図 4.18 は光量チェック及び MPPC 交換後の全チャンネルの光量ピーク分布である。黒い線はトラッキング プレーンを表し、赤い線は VETO プレーンを表している。表 4.4 にはそれらの分布の中心値 (p.e.) 及び RMS (p.e.) を示してある。これから見ても分かるように、VETO プレーンの光量ピークはトラッキングプレーンの



図 4.17: 光量ピークを各チャンネルごとにプロットした図。トラッキングプレーン4枚について載せてある。 赤い点線は図 4.11(b) で求めたガウス分布の中心値を表し、実線はその ±3σ を示している。

表 4.3: 全トラッキングプレーンのチャンネル (48×11) 光量チェックの結果

ファイバーに損傷	MPPC の光電面に汚れ	問題なし
0	1	1231

それに比べ全体的に40%も低い事がわかる。この原因について、次のように考察してみた。

VETO プレーンは2モジュール分の8枚を重ね試験を行ったが、モジュールの底部に設置される Bottom プレーン用のシンチレータは他のプレーンに比べ約20cm 短い。図4.19は試験時の VETO プレーンの設置を示した図で、上2プレーンが Bottom プレーンである。データ取得に際しては宇宙線が全てのプレーンを突き抜けた場合に Cosmic trigger を配るようあらかじめ設定してある。したがって一番上のBottom プレーン (茶色)がアクセプタンスを決めてしまう。よって下に積まれた VETO プレーン 6枚は読み出し位置から20cm 近くの領域の光量は検出されにくい。さらに、シンチレーション光はファイバーに吸収・発光されて MPPC までに到達するまでに減衰する。つまり読み出しから遠くなるほど低い光量が検出される。読み出し光量*LY* は読み出しから位置 (今の場合は MPPC の位置) からの距離*1*を用いて次のように表される。

$$LY = A \times \exp\left(-\frac{l}{\alpha}\right) \tag{4.4}$$

A は読み出し位置における光量である。過去のビーム照射試験より α は 241.7 cm であることがわかっている。この減衰の効果をみるため、次の計算を行った。

簡単のため、宇宙線が長さ 130 cm のシンチレータ (VETO プレーン用) と長さ 120 cm (トラッキングプレーン用) のシンチレータを天頂角 0° で一様に通過した場合を考える。そして、130 cm のシンチレータに対して は読み出し側 20 cm の領域には宇宙線は来ないと仮定する。一般に l_1 から l_2 ($l_2 > l_1$) の領域に通過した宇宙 線から得られる平均光量 < LY > は式 (4.4) を用いて次のように書ける。

$$<$$
 LY $>= \frac{A}{l_2 - l_1} \int_{l_1}^{l_2} \exp\left(-\frac{l}{\alpha}\right) dl$ (4.5)

αは241.7 cm であり、予想される平均光量の違いは次のようになる。

$$< LY >_{Tracking} = \frac{A}{120} \int_{0}^{120} \exp\left(-\frac{l}{241.7}\right) dl$$

$$< LY >_{VETO} = \frac{A}{130 - 20} \int_{20}^{130} \exp\left(-\frac{l}{241.7}\right) dl$$

$$\frac{< LY >_{Tracking} - < LY >_{VETO}}{< LY >_{Tracking}} \simeq 0.13$$
(4.6)

すなわち違いは13%程度であることがわかった。

だが、実際の違いは40%ほどであり、まだ残りの27%は今のところ原因が分かっていない。しかし、VETO プレーンの光量ピーク分布が全体で低い方へシフトしているため、何か別の系統的な要素が含まれていると 考えられる。VETO プレーンの光量については現在も引き続きチェックをしている段階である。

表 4.4: トラッキングプレーンと VETO プレーンで得られた光量ピーク分布の中心値とその RMS

	Tracking plane	VETO plane
中心值 (p.e.)	26.04	15.72
RMS (p.e.)	3.50	2.85



図 4.18: INGRID shoulder module の全チャンネルの光量ピーク分布。黒い分布はトラッキングプレーンを表 し、赤い分布は VETO プレーンを表している。5 p.e. 付近にみられるチャンネルはファイバー及び MPPC を 交換しても光量が回復しなかったチャンネル。表 4.4 にはこれら分布の中心値と RMS を示している。

4.2.3 組み立て作業・インストール

INGRID shoulder module に使用される MPPC のノイズ評価及び宇宙線による光量評価を行った後に、同じ く HENDEL 棟にて組み立て作業を行った。フランスにより製作された鉄の構造体 (図 4.20) の隙間にトラッ キングプレーンを 11 枚挿入し、その後 VETO プレーン4枚を周りに設置する完成したモジュールは前置検出 器ホールに運ばれ、インストールが開始された。図 4.21 はホールに運び込まれた後の shoulder module であ



図 4.19: VETO プレーンの試験のセットアップ。一番上の Bottom プレーンが宇宙線に対するアクセプタンス を決めてしまう。右図は左図を上から見たもの。

る。10月16日 module14 が無事インストールを終え、その翌日17日に module15のインストールを終えた。





図 4.21: 前置検出器ホールに運び込まれた後の INGRID 図 4.20: フランスにより制作された鉄の構造体。鉄の shoulder module。足場となる構造体も一緒に写ってい 隙間にトラッキングプレーンを挿入していく。 る。

第5章 ミューオンモニターを用いたT2K実験デー 夕解析

この章では、

- ミューオンモニターによる解析方法の説明
- Good spill selection の定義
- 2010年1-6月までの物理ラン (2010a) のデータ解析結果
- 2010年7-10月のシャットダウン期間におけるミューオンモニターのアップグレード
- 2010年11月からの物理ラン (2010b) のデータ解析結果

について述べていく。

表 5.1 には T2K 実験のこれまでのスケジュールを示した。T2K 実験は 2010 年の1月から物理ラン (以降、 2010a と呼ぶ)を開始した。2010 年の夏に行われたシャットダウンを挟み、2010 年 11 月からの物理ラン (以降、 2010b と呼ぶ) は強度を上げるため陽子ビームのバンチ数及びスピル周期が表 5.2 のようにアップグレードしている。これにより、バンチ当たりの陽子数が同じでも、強度は 2010a データに比べて 1.47 倍に増強した。図 5.1 には 2011 年 1 月現在まで POT¹、また、1 スピル当たりの陽子数 (proton per pulse)の経緯を載せた。このプロット中の Total POT には物理ランと、ビーム調整やビームスタディ等の物理ラン以外の運転における POT も含まれている。物理ランでは、2011 年 1 月現在までに ~ 7.5 × 10¹⁹ POT の統計量を貯めている。

表 5.1: T2K 実験これまでのスケジュール (2011 年 1 月現在)

スケジュール
物理ラン (2010a)
シャットダウン
(メンテナンス作業、ハードウェアアップグレード、新検出器インストール等)
物理ラン (2010b)

¹Protons on Target: 炭素標的への陽子の照射数

	バンチ数	スピル周期
2010a	6	3.52
2010b	8	3.20

表 5.2: 2010a と 2010b の陽子ビームのバンチ数及びスピル周期の変化



図 5.1: 2011 年 1 月現在までの POT 数と1 スピル当たりの陽子数の経緯

5.1 解析方法

ここではミューオンモニターを用いたミューオンビームのプロファイル再構成方法について述べていく。

座標系の定義

ミューオンモニターが取り入れている座標系の定義は加速器側のものと統一している。ビームが進む方向 を正のZ方向として、一般に用いられる右手系ではなく、左手系を用いている。

ミューオンビームのプロファイル再構成

ミューオンビームは 49 チャンネルあるシリコン PIN フォトダイオードとイオンチェンバーによって同時に 検出される。検出された信号は図 5.2 のように FlashADC によって波形取り込みを行う。そして収集電荷量 を求めるため、各バンチごとに波形積分を行う (図 5.3(a))が、その積分の開始位置は全て、1 次ビームライン に設置された最下流にある陽子ビームモニター CT (以下 CT5 と呼ぶ)からの時間情報を使っている。具体的 には陽子ビームの波形ピークの位置 (図 5.3(b))で決めている。こうすることで、陽子ビームとタイミングを 合わせている。積分範囲の長さはバンチ幅のデザイン値 (581 ns) に対応させるため、37 sample² (~570 ns) と している。求めた積分値に対し、ペデスタルを差し引く。ここで、ペデスタルとは、バンチがくる前の信号 及び最後のバンチから 20 sample 後の信号の平均値としている。こうすることで、純粋な収集電荷量を求め ることができる。なお、ADC カウントから電荷の値 (C) への較正値は、3.3.1 章で述べたエレクトロニクス キャリブレーションによって求めている。1 スピルごとに求めた各チャンネルの収集電荷量は図 5.3(c) のよ うに実際の検出有効面積に合わせた 7×7 のマス目に詰めていき、2 次元ヒストグラムを作る。得られたヒス トグラムについて、2 次元ガウス分布 (式 5.1) によりフィットを行うことでプロファイルを再構成している。

$$F(x,y) = A \exp(-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{(y-y_0)^2}{2\sigma_y^2})$$
(5.1)

ここで、A はフィット関数のピーク値を表し、 x_0 、 y_0 はそれぞれ x 方向と y 方向プロファイル中心、 σ_x 、 σ_y はそれぞれ x、y 方向のプロファイル幅を表している。このプロファイル再構築はシリコン PIN フォトダ イオードとイオンチェンバーで独立に行われる。

ミューオンビームの方向の決定

式 (5.1) で求めたプロファイル中心がビーム方向となる。尚、1 mrad はミューオンビームの測定値 11.8 cm に対応する。

²65MHz sampling の FlashADC を用いているので、1 sample あたり 15.4 ns である。

muon yield の決定

シリコン PIN フォトダイオードとイオンチェンバーで得られたそれぞれの 49 チャンネル分の収集電荷量 もデータとして記録される。ここで、この 49 チャンネルの収集電荷量の総和に対し CT5 で測定した陽子数 を割ることで、陽子数あたりのミューオンの生成量、muon yield がわかる。



図 5.2: FlashADC によって読み出されたシグナル波形。(a) シリコン PIN フォトダイオード (b) イオンチェ ンバー



図 5.3: プロファイル再構成の手順。(a) は FlashADC によって読み込んだ波形に対し各バンチごとに積分範囲 を示している。赤い実線は積分範囲の開始位置を示し、赤い点線は積分範囲の終了位置 (開始位置+37 sample) を示す。この積分範囲は CT5 で測定された波形ピークの位置によって各バンチごとに決めている (b)。(c) 得 られた 49 チャンネルの収集電荷量を 7 ×7 の 2 次元ヒストグラムにつめたもの。これを 2 次元のガウス分布 でフィットする事でプロファイルを再構成する。

5.2 Good spill selection

Good spill selection とは物理データとして提供するビームデータを選別する方法である。得られた全ての データに対し以下の条件が課せられ、選別を行う。

物理ラン

そのイベントがビーム軌道調整やモニタースタディのランではなく、あらかじめ物理ランとして割り当 てられていたものか確認する。

- ビームトリガー ON 加速器側からのトリガーが来ていたイベントかどうか確認する。
- Good GPS Status

T2K 実験では 2 つの GPS 受信機を用いており、原子時計が搭載されていてる GPS 衛星から 1 秒毎ご とに UNIX 時間と位置情報がこれら受信機に送られる。2 つの GPS 受信機はこれら情報を受け取る度 にパルス信号: 1 PPS (Pulse Per Second)を出力し、100 MHz クロック信号で動作している LTC (Local Time Clock) モジュールに入力され、クロック数が記録される。続いて加速器側から送られたビームト リガーもこの LTC に入力され、このクロック数も記録される。この 2 つのクロック数と GPS 受信機が 受け取った UNIX 時間を用いることで、ビームトリガーの UNIX 時間を計算できる。そして、2 つの GPS 受信機から得られた 2 つのビームトリガーの UNIX 時間の差を記録し、これが常に 200 ns 以下で あることを確認する。

- CT5 で測定した1スピル当たりの陽子数>1×11 protons per spill 機器の異常により Machine Protection System (MPS) や Person Protection System (PPS) が作動した直後 は加速器からのビームトリガーが来ていてもビームが来ない場合がある。そのようなイベントを避ける ために課せられる条件である。
- Normal condition cut これは何か予想外のアクシデント (検出器が止まる、等) があった場合にそういったイベントを切り捨 てるカット条件である。

• Horn current cut

電磁ホーン電流値が設定値の 2%以内に抑えられているかどうかの確認する。これは 2%以内の変動で あれば SK で振動確率が最大になるニュートリノエネルギー (0.5-0.7 GeV) のフラックス変化を 2%(T2K 実験で課せられている許容値) よりも小さく抑えられる事から、この条件が定められた。

• Muon monitor cut

これは最後に課せられる条件である。ビーム方向が x、y 方向共に 1 mrad 以下であるかどうかの確認、 及び muon yield が各ランの平均値の 5%以内に抑えられているかどうかを確認する。1 mrad 以内とい う条件は、T2K の Off-Axis 法を実現するために定められている。また、muon yield が 5%以内という条 件は次の理由による。5.3.1 章でも述べるが、現在 muon yield の測定分解能はおよそ 0.5%である。した がって、5%変わるという事は、実際に muon yield が減少しているか、何か測定に異常がある可能性が 大きい、という事になる。当然、5%という許容値はかなり多めに見積もっている。実際のデータ取得 では、明らかな測定値の変化があったらすぐに原因究明にあたっている。 この選別によりふるいにかけられ、生き残ったイベントが T2K 実験の物理データとして用いられる。

5.3 2010a データ解析

2010aにおける加速器で割り当てられたラン番号は表 5.3 の通りである。ここでは、以下について述べる。

- ミューオンモニターの測定分解能
- 電磁ホーン電流に対する muon yield の依存性
- 運転時のトラブル
- 物理ランで得られたビームの安定性

ここでは、解析に使用したデータは全て 2010a データである。図 5.4 はこの期間のビーム運転におけるビー ム強度のヒストリープロットを表している。最大で 100kW のビーム強度を達成したが、これは試験的なもの で、物理データとして扱われていない。0kW 付近に多くの点が存在するが、これは加速器側及びニュートリ ノビームライン側で MPS が作動した事等によりビームが来ていないイベントである。電磁ホーンは 3 台とも 250 kA に励磁させてのビーム運転となっている。

表 5.3: 2010a における加速器で割り当てられたラン番号とその期間

期間 (2010 年)	ラン番号
1/23 - 2/4	29
2/23 - 3/1	30
3/18 - 3/25	31
4/13 - 5/13	32
5/9 - 6/1	33
6/7 - 6/26	34

5.3.1 強度 方向測定分解能

ミューオンモニターの測定分解能の決定は実際にビームを用いて行った。しかし、常にビームパラメータ が一定のビームを出す事は不可能なため、測定値には様々な不確定要素が含まれる。しかし、シリコン PIN フォトダイオード及びイオンチェンバーから得られた測定結果を用いる事で、ミューオンモニターが持つ測 定分解能の上限値を決定した。

シリコン PIN フォトダイオードで得られる全収集電荷量とイオンチェンバーで得られる全収集電荷量の比 を計算する事で、強度測定にふらつきを与える要因 (陽子ビーム強度・電磁ホーン電流値)を打ち消す事が出 来る。図 5.5(a) は6時間ほど貯めたデータを用いて、この2つの検出器で得られた収集電荷量の比の分布を



図 5.4: 2010 年 1 月から 6 月末までのビーム運転におけるビーム強度の経緯。0kW 付近のイベントは MPS が 作動してビームが来ていないイベントである。

とったものである。 δQ_{Si} 、 δQ_{IC} をそれぞれシリコン PIN フォトダイオードとイオンチェンバーの真の強度測 定分解能 (%) とすると、この分布の RMS/Mean は式 (5.2) のように考えられる。

$$(RMS/Mean)_{Si/IC} = \sqrt{\delta Q_{Si}^{2} + \delta Q_{IC}^{2}}$$
(5.2)

また同じようにして、2つの検出器で得られたミューオンビームのプロファイル中心の差を x、y 方向にそ れぞれ求める事で、真の方向測定分解能の上限値が得られる。図 5.5(b) は (a) と同じデータを用いて、x 方向 について、プロファイル中心の差の分布をとったものである。 δx_{Si} 、 δx_{IC} をそれぞれシリコン PIN フォトダ イオードとイオンチェンバーの真の方向測定分解能 (cm) とすると、この分布の RMS は式 (5.3) のように考え られる。

$$(RMS)_{Si-IC} = \sqrt{\delta x_{Si}^2 + \delta x_{IC}^2}$$
(5.3)

方向測定分解能の場合は炭素標的における陽子ビームの入射角度のふらつきの影響を受けるので、これも考慮しなければいけない。表 5.4 はあるビーム強度ごとに求めた、これらミューオンモニターの強度及び方向測定分解能の上限値であるが、ビーム強度が上がるにつれ良くなっているのは検出器の S/N 比 (Signal-to-Noise ratio) が良くなっているためと考えられる。そして、求めた測定分解能は、どの強度においてもミューオンモニターに課した目標測定分解能である 0.3 mrad(=3.54 cm)、及び 3%よりも遥かに良い精度である。

5.3.2 電磁ホーン電流の依存性

Full dependence study

電磁ホーンの電流値が上がることで、放出角度の大きいπ中間子が収束し、前方に向かうニュートリノが 増え、結果として SK におけるニュートリノフラックスが増える。この収束効果をミューオンモニターで確か



図 5.5: (a) 強度測定分解能の算出。シリコン PIN フォトダイオードで得られた全収集電荷量をイオンチェン バーのそれで割ったものである。この分布の RMS がミューオンモニターの強度測定分解能の上限値となる。 (b) 方向測定分解能の算出。図はシリコン PIN フォトダイオードで得られたプロファイル中心とイオンチェン バーのそれとの差をとったものである。この分布の RMS がミューオンモニターの方向測定分解能の上限値 となる。

ビーム強度 (kW)	18.7	27.0	31.0	39.5	43.0	51.7
強度測定分解能(%)	0.20	0.16	0.12	0.10	0.07	0.07
方向測定分解能 (cm) (x)	0.58	0.30	0.27	0.26	0.24	0.19
(y)	0.46	0.35	0.24	0.19	0.18	0.17
陽子ビーム入射角度 RMS (mrad) (x)	0.045	0.055	0.054	0.055	0.022	0.005
(y)	0.014	0.013	0.014	0.012	0.013	0.012

表 5.4: ミューオンモニター測定分解能
めるためのモニタースタディが行われた。図 5.6(a) はホーン電流値を徐々に上げていき、ピーク電荷³の推移 を見たものである。左図はホーン 2、3 の電流値を 0 kA に落とし、ホーン 1 のみの電流値を 0-320 kA まで変 化させたプロットで、右図はホーン 1 の電流値を 320 kA に固定しておき、ホーン 2、3 の電流値を 0-320 kA と変化させたプロットである。また図 5.6(b) はミューオンビームのプロファイル幅を (a) と同じ横軸でプロッ トしたものである。黒い点は x 方向のプロファイル幅を、赤い点は y 方向のプロファイル幅を示している。 全てのホーン電流値が 0 kA の時と 320 kA の時を比べるとピーク電荷はおよそ 7 倍増え、またプロファイル 幅も狭くなっている。これより、π 中間子の収束を確認し、そして前方に向かうニュートリノが増えている ことを確認した。

ホーン1の電流値 150 kA 付近でプロファイル幅が少し浮き上がっているのが見える。これは定性的に次 のように考えられる。図 5.7(a) はホーン1の電流値が0(青色)、150(赤色)、320(黒色) kA (ホーン2、3の電 流値は0 kA) のプロファイル幅 (左: y=0 におけるスライス、右: x=0 におけるスライス) を示したものであ る。これらの分布をそれぞれ0 kA の時の中心 (x=0、y=0) の電荷量に合わせてスケールしたものが図 5.7(b) である。全体として muon の収量を増えているものの、150 kA の時で一番幅が広くなっている事がわかる。 さらに詳しく見るため、ミューオンモニターに到達する π 中間子の位相分布をビームラインシミュレーショ ン「JNUBEAM (付録 C.1 を参照)」を用いて図 5.8 のように求めた。左から horn1 電流値 (a)0、(b)150 (どち らもホーン2、3 の電流値は0 kA) に対応している。(c) は (b) と (a) の比をとったものである。(c) の図を見 ると、0-0.02 rad の前方散乱の π 粒子を親粒子に持つ muon の増加はあまり見られないが、0.02-0.05 rad の π 粒子は増えている。つまり、この領域の π 中間子はホーン電流によって収束され、ミューオンモニターにお ける muon の収量を増やしている。しかし、収束の効果が小さいため、ミューオンモニターの検出領域全体 にわたり muon が到達するため、結果としてプロファイルの幅が大きくなってしまったと考えられる。

Horn current fluctuation study

物理ラン中、ミューオンモニターでもホーンの電流値をモニターできるか確かめるため、電流値の少しの 変動に対し、muon yield がどう変化するかを調べた。図 5.9 はホーン電流値が 250 KA 付近の変動に対する muon yield の変化をみたものである。図 5.9(a) はホーン 2、3 の電流値を 249 kA に固定し、ホーン 1 の電流 値を 250 kA から ±1%変化したときの muon yield を表したもので、リニアな相関が見られる。同様に図 5.9(b) はホーン 1 の電流値を 250 kA に固定し、ホーン 2、3 の電流値を 249 kA から ±1%変化させたものである。

また図 5.10(b) はホーン電流値が 320 kA 付近の変動に対する muon yield の変化をみたものである。図 5.10(a) はホーン 2、3 の電流値を 317kA に固定し、ホーン 1 の電流値を 317 kA から-1%、-2% と変化させた時の muon yield を表す。そして図 5.10(c) はホーン 1 の電流値を 321 kA に固定し、ホーン 2、3 の電流値を 321 kA から-1%、-2% と変化させたものである。やはりどちらもリニアな相関が見られている。これら結果は表 5.5 に示した。

ここで、ミューオンモニターがどれだけホーン電流値の変動に感度があるか考察する。既に述べたように、 ミューオンモニターは 0.2%以下の強度測定分解能を得ている。muon yield は全 49 チャンネルから得た総収

³式 (5.1) の A の項



(b)

図 5.6: (a) ホーン電流値とピーク電荷の関係。シリコン PIN フォトダイオードの測定値を用いている。左図 はホーン 2、3 の電流値をゼロとし、ホーン 1 の電流値のみを 0-320 kA まで変化させたもので右図はホーン 1 の電流値を 320 kA の固定し、ホーン 2、3 の電流値を 0-320 kA まで変化させている。ホーン 3 台が 320 kA の時は 0 kA の時に比べピーク電荷が 7 倍にも増えている。(b) ホーン電流値とプロファイル幅の関係。横軸 は (a) と同じで、縦軸をプロファイル幅にしたものである。こちらもシリコン PIN フォトダイオードの測定 値を用いている。150 kA 付近で浮き上がっているが、基本的にホーン電流値が増えるに従いプロファイル幅 も狭くなっている。



(b)

図 5.7: (a) ホーン 1 の電流値 0 kA (青色)、150 kA (赤色)、320 kA (黒色) のプロファイルのスライス図。ホーン 2、3 の電流値は 0 kA のままである。左図は Y=0 のスライスで、右図は X=0 のスライスである。(b) (a) の スライスの分布に対して、(X,Y)=(0,0) の値を 0 kA の値にスケーリングさせたもの。150 kA (赤色) の分布で 最も幅が広い事が分かる。



図 5.8: ミューオンモニターに届く muon の親粒子である π 中間子の位相分布。ビームラインシミュレーション (JNUBEAM) を用いて求めている。(a) はホーン 1 が 0 kA の時で (b) は 150 kA の時の図である。(c) は (a) に対する (b) の比をとったもので、放出角が 0.02-0.05 rad の領域で山が見える。つまり、この領域の π 中間子から生まれるミューオンモニターに届く muon の量が 150 kA の時で増えていることが分かる。

集電荷量に対して、CT5 で求めた陽子数で割ったものである。そして、CT5 の陽子数測定分解能は 0.5%である事がわかっている。したがって muon yield の測定分解能はこれらの Quadratic sum、

$\sqrt{(0.2\%)^2 + (0.5\%)^2} = 0.54\%$

となる。したがって、ほとんど CT5 の陽子数測定分解能 (=0.5%) で決まっている。また表 5.5 より、ホーン 1 の電流値が 250 kA から 1%変化すると muon yield は 1%変化する。ミューオンモニターはおよそ 0.5%の muon yield に感度があるので、つまりホーン 1 の電流値 0.5%(~1.3 kA) の変動に感度がある事がわかる。同 様に考えて、ホーン 1 の電流値が 320 kA から 1%変化すると、muon yield は 1.5%変化するので、この場合 ホーン 1 の電流値 0.3%(~1 kA) の変動に感度がある事がわかる。



図 5.9: ホーン電流値 250 kA 付近から 1%程度の変動における muon yield の変化。シリコン PIN フォトダイ オードで得られた測定値を用いている。(a) はホーン 1 の電流値を、(b) はホーン 2、3 の電流値を 1%変化し た図を表している。これら変化に対し、muon yield はリニアに相関している。



図 5.10: ホーン電流値 320 kA 付近から 1-2%程度の変化における muon yield の変化。シリコン PIN フォトダ イオードで得られた測定値を用いている。(a) はホーン 1 の電流値を、(b) はホーン 2、3 の電流値を-1~2%変 化した図を表している。これら変化に対し、muon yield はリニアに相関している。

Horn1	Horn2&3	muon yield
250 kA±1%	250 kA	±1.0%
250 kA	249 kA±1%	±0.8%
321 kA ^{-1%} _{-2%}	317 kA	-1.5% -3.0%
321 kA	$317^{-1\%}_{-2\%} \mathrm{kA}$	-0.8% -1.6%

表 5.5: ホーン電流値の変動に対する muon yield の変化

5.3.3 運転時のトラブル

物理ラン中、ミューオンモニターは以下の2つのトラブルに見舞われた。

HV 値の IOC への受け渡しの失敗

イオンチェンバーのガス圧、温度、また酸素濃度の値は IOC に受け渡しているが、それと同様に検出器に かけている電圧値も IOC に受け渡し、そのタイムスタンプを記録している。しかし、電圧値の IOC への受 け渡しが止まった事でタイムスタンプの記録が止まり、スローモニターからアラームが発せられた事があっ た。問題解決のため一度電圧を落とし、ビーム供給をとめ、再び電圧を上げることで、この問題は解決され た。しかし、電圧を落としている最中もビームが来ていたため、計 65 イベントが Good spill selection により 物理データから落とされた。

Transceiver module の不良

読み出し回路 (図 3.13) 内にある Transceiver は加速器からのトリガー信号を受け取っているが、この動作が 不調になり、FlashADC に入力するゲート信号がふらつくという事態が生じた。そのため、積分範囲に信号 が入らず、見かけ上 muon yield が減ってしまうという問題が起きた。幸い、そのふらつきは 200 ns 程度であ り、またオフライン解析の結果によって波形積分が可能であった。一度 good spill selection によって該当イベ ントは落とされたが、最終的に全てのイベントが物理データとして用いられる事になった。また、動作不良 となったこの Transceiver module は新たなものに取り替えられた。

結果としてミューオンモニターのトラブルによって good spill selection から外されたイベントは 65 イベン トであり、物理ラン中の Live time は 99.95%であった。これはほぼ全てのイベントで安定して稼動している 事を意味している。

5.3.4 ビームの安定性

図 5.11、5.12 はそれぞれ good spill selection で生き残ったイベントにおける、ミューオンビームのプロファ イル中心、及び muon yield のヒストリープロットを示している。これらの図は全て S/N 比がより良いシリコ ン PIN フォトダイオードの測定値を用いて 1 スピルごとにプロットしたものである。また表 5.6 には各 MR ランにおけるこれらの値の結果を示している。Run34 の途中、ミューオンモニターはビーム軸に対し、Y 方 向に-2.5 cm の位置に間違って設置されている事が判明した。そのため Y 方向におけるプロファイル中心は およそ-2.5 cm ずれている。しかし、物理要請である 1 mrad 以内には十分に収まっている。また muonyield に関して、途中 Run33 で大きなふらつきが見える。これはビーム強度を上げた事で、CT の Attenuator を変 えたため、S/N 比が小さくなったことによる。しかし、2010a においては、RMS/Mean がおよそ 1%以内に収 まっている。これにより、非常に安定なニュートリノビームの供給がなされている事を確認した。



図 5.11: 2010a データで得られたビーム方向の測定結果

	Profile center (cm)		muon yields	
MRrun	x (Mean \pm RMS)	y (Mean \pm RMS)	Mean (nC/ 10^{12} ppp)	RMS/Mean (%)
Run29	-0.05 ± 0.36	-0.55 ± 1.06	33.35	0.58
Run30	-0.86 ± 0.65	-2.31 ± 0.57	33.43	0.50
Run31	-0.46 ± 0.50	-2.81 ± 0.21	33.47	0.38
Run32	-0.14 ± 0.59	-2.56 ± 0.30	33.52	0.28
Run33	-0.20 ± 0.52	-2.46 ± 0.28	33.55	1.02
Run34	-0.30 ± 0.52	-2.49 ± 0.52	33.60	0.25
Total	-0.10 ± 0.62	-2.46 ± 0.53	33.53	0.68

表 5.6: ミューオンモニターによるミューオンビームの方向 · 強度の測定結果



図 5.12: 2010a データで得られた muon yield の測定結果

5.4 夏のシャットダウンに行われたミューオンモニターアップグレード

2010 年 7 月から 10 月の間はビームは止まり、その間色々な方面でハードウェアの調整、アップグレード 及び新検出器のインストールが行われた。ミューオンモニターでも 2010 年 11 月から始まる物理ランに備え、 ハードウェアのアップグレードが行われた。

5.4.1 Attenuator の変更

従来使用していた NIM 規格の Attenuator では減衰率を変更する際、モジュールの蓋を開けてチップを手 作業で交換していた。これはミューオンモニターだけでなく、他のビームモニターでも同様に行っており、 この作業だけで1時間以上もかかってしまうため、大きな時間のロスが懸念されていた。これを改善するべ く、遠隔操作によって減衰率を変更できるように、新しい VME 規格の Attenuator を導入する事になった。図 5.13(a) はこの Attenuator の回路図で、(b) は写真である。1 台につき 12ch を有し、スイッチングリレーによ り、減衰率を変更できる仕様になっている。また、Attenuator 一つ一つに IP アドレスを与え、ローカルネッ トワークに接続することで、PC からの操作が可能となっている。またこれにより、モニター責任者以外の者 による遠隔操作もスムーズに行われるようになった。

この VME 規格の Attenuator を導入するに際して、入力信号に対する線形性を調べる試験を 1 MHz、10 Mz、 そして 100MHz と周波数を変えて行った。入力信号はファンクションジェネレータによって作り、実際にミュー オンモニターで観測される波形に近づけるため、正弦波を入力信号とした。図 5.14 はこの試験のセットアッ プである。まず入力信号を直接オシロスコープで読み、波形積分を行う。続いて、VME 規格の Attenuator に 入力して、その出力をオシロスコープで読み波形積分を行った。そして出力の波形積分値と入力の波形積分 値の比をとり、線形性を調べた。図 5.15 がその結果であり、全ての測定点で 1%以下の線形性が得られてい る。これは従来使用していた NIM 規格の Attenuator と同程度の線形性である事が分かり、実機としての使用 で問題ない事が分かった。

5.4.2 電圧印加回路の変更

図 5.16 はこれまでミューオンモニターで使用してきた電圧印加回路である。(一緒に読み出し回路と検出器 も描かれている。)これには以下の3つの問題点を抱えていた。

- 直流電源が古く、予備も無い状況 これまでは CAMAC モジュールの電源 (REPIC RPH-32010) を用いていたが、これは古いもので、また 予備は無かった。そのため、電源そのものを刷新する事にした。2010 年 11 月からの物理ランでは松定 プレシジョン株式会社製の直流電源「PL-650-0.1」を用いている。
- 2. 電源の直下に置かれている Low Pass Filter (LPF) では高いビーム強度で問題が生じる。 2009年の夏に京都大学化学研究所先端ビームナノ科学センターにある 100 MeV 電子線形加速器 (LINAC) を用いたビームテストを行い、LPF に用いられる抵抗値 (図 5.16(a) 中、赤文字で書かれた 100 kΩ 抵抗) を変えたテストを行った。検出器 (シリコン PIN フォトダイオード) に電子ビームを当て、その出力波 形を見ると、収集電荷量 20 nC ほどのところで線形性が失われるという問題が発覚した。(図 5.16(b))。



Relays (up to 100V)



図 5.13: (a)VME attenuator の回路図。スイッチングリレーにより減衰率が変化する仕組みとなっている。また出力は 1.5 V を超えないようにツェナーダイオードを入れている。(b)VME attenuator の写真



図 5.14: VME attenuator のリニアリティ試験におけるセットアップ

これは T2K 強度 (ホーン電流値: 320 kA) に換算すると、およそ 160 kW 相当のところで線形性が失わ れるのに等しい。そのため、このままではこの LPF を使用することは不可能であり、回路構成を一新 することが必要不可欠であった。

3. 反射波の問題

これまでミューオンモニターで得られた信号では波形の立ち下がった後に反射波のようなものが見えて いた。これを調べてみると、LPF で用いられている抵抗起因による可能性が大きい事が分かった。この 抵抗は 2. で問題となっていた抵抗と同一のものであり、より一層 LPF の交換が必要である事をしらし めた。

新たな電源はこれまでの多出力型ではなく、単出力型とした。そのため Divider を介し検出器に電圧を供給 する必要があった。また LPF に使用していた抵抗は 51Ω に変え、インピーダンス不整合による反射波を防 止した。図 5.17 に 2010 年 11 月の物理ランから使用した電圧印加回路を載せた。新たな回路は Pre-Divider、 そして Divider を介し、1 台の電源で最大 56 チャンネル分の検出器に電圧を印加できるようにしている。図 5.18 に Divider の写真を載せた。

5.5 2010b データ解析

2010 年 7-10 月まで続いたシャットダウンを終え、11 月より物理ラン (2010b) が再開された。2010b では 2011 年 6 月までのデータ取得をする予定である。ここでは、2010 年 11-12 月の 1ヶ月の物理ランのデータ解 析の結果について述べる。具体的には、

- 2010a からの変化
- 2010b における測定分解能
- ビームの安定性











図 5.15: VME attenuator のリニアリティ。(a) は 0dB、(b) は 15dB、(c) は 30dB の減衰率の試験結果を表して いる。



図 5.16: (a)2010 年 1 月-6 月末の物理ランで使用された電圧印加回路。(b) (a) 内の赤文字で書かれた抵抗値を 変えたテスト結果。このテストは京都大学化学研究所先端ビームナノ科学センターにある 100 MeV 電子線形 加速器 (LINAC) を用いて行われた。左図は 0 kΩ を用いたときのシリコン PIN フォトダイオード (リファレ ンス用) と 100kΩ を用いたときのシリコン PIN フォトダイオード (テスト用) の収集電荷のリニアリティを見 たもの。赤い線はリファレンス用シリコンの収集電荷 0-20nC までをフィット範囲として 1 次直線を引いたも の。テスト用のシリコンの収集電荷が 20 nC を超えたところでリニアリティが失われている。右図は各抵抗 値におけるシリコンで得られた波形をみたもの。



図 5.17: 2010 年 11 月から用いている電圧印加回路。電源の出力が 1 チャンネルしかないため、Pre-Divider・Divider を用いて分岐させている。Pre-Divider 内のツェナーダイオードは設定よりも高い電圧を加 えるのを防ぐために入れている。Divider 内の 51Ω は反射波を防ぐためのものである。



図 5.18: 現在使用している Divider の写真。この回路では 1 ch の入力から 14 ch に分岐出力するように作られ ている。この回路には 1 μ F のコンデンサーと 51 Ω の抵抗を用いている。

について述べる。

この期間の物理ランは表 5.7 に示すように、Run36 として割り当てられている。Run36 からビームの仕様 が変わった。まず、1 スピル当たりのバンチ数は8 に増え、スピル周期も 3.52 秒から 3.20 秒へと短くなった。 これにより、1 秒当たりの POT は 1.47 倍に増えた。図 5.19 に Run36 で得られたビーム強度の経緯を示す。 ビーム強度は最大で 135 kW に達した。ただしこれは試験的なもので、実際に物理ランとして扱われていな い。電磁ホーン 3 台は 250 kA に励磁させてのビーム運転となっている。

表 5.7: 2010b における加速器で割り当てられたラン番号とその期間。Run37 までを示した。

ラン番号

36

27

期間 (2010 年)

11/18 - 12/24

140 120 100 80 60 40 20 0 Nov 18 Nov 25 Dec 02 Dec 09 Dec 16 Dec 23 AM09:00 AM09:00 AM09:00 AM09:00 AM09:00 AM09:00	140 120 100 80 60 40 20 0 Nov 18 Nov 25 AM09:00	v 25 Dec 02 Dec 09 Dec 16 Dec 109:00 AM09:00 AM009:00 AM009:00 AM009:00 AM009:00 AM009:00 AM000 AM0000 AM0000 AM000 AM000 AM0000 AM00000 AM00000 AM000000 AM000000 AM00000000
140 -	140 120 100 80 60 40 20	
140 120 120 100 100 100 80 100 60 100 40 100	140 120 100 100 80 40 20	
140 120 100 80 60 40	140 120 100 80 60 40	
140 120 100 80 60		
140 120 100 80	140 120 100 80	ور میشود وسید ، ایند وسید . میشود وسید و میشود . میشود وسید و میشود . ا
	120 100	المربيعة (المربيعة (المربيعة (المربيعة (المربيعة (المربية (الم
	120	ن الأمرين ونبيلانه بارسنان ، الا فانتان . ا
140		
	140	

図 5.19: Run36 のビーム運転におけるビーム強度の経緯

5.5.1 2010aからの変化

電磁ホーン電流値

シャットダウン期間中にて、これまで使用していた電磁ホーンの電源が新しいものに換えられた。それに 伴い、2 台用いていた電源も、1 台に台数を減らした。しかし、新しい電源では電流値が 3 段階に変わって しまう問題が生じた。図 5.20 は物理ラン中に得られた電磁ホーン電流値の分布を示している。黒色、赤色、 青色の分布はそれぞれホーン 1、2、3 の電流値を表す。シャットダウン前に行われていた Run34 の分布を各 ホーンの電流値が安定的に分布しているのに対し、今回の Run36 はどのホーンの電流値も3つの分布に分か れている。実際に電流値が変動しているかどうかを確かめるため、ミューオンモニターで測定される muon yiled との相関を見たのが図 5.21 である。これを見ると明らかに相関があるのがわかる。ホーン電流値1%の 変化に対し、1.9% muon yield 変化している。5.3.2 章で述べた Horn current fluctuation study において、表 5.5 より全てのホーン電流値を1%変化した時、muon yield の変化量は1.8%であり、今回の結果とほぼ一致して いる。したがって、まぎれもなく電流値は3段階に変動していると結論付けた。

今回の変動は最大で±1.5 kA (~0.6%) ほどであり、5.2 章で述べた Good spill selection 内には収まっている。 よって、電源の調整はせずにこの状態で物理ランが行われることになった。



図 5.20: Run34、Run36 におけるホーン 1(黒色)、2(赤色)、3(青色)の電流値分布。Run36 ではホーンの電流値が3 段階に変動している。

バンチごとのビーム方向

シャットダウンの期間、加速器側で磁石の調整などが行われ、またバンチ数も8になった事により、バン チごとに測定量が安定しているか確かめる必要があった。そこでビーム方向について、各バンチごとに調べ た。表 5.8 は解析に使ったデータセットである。過去のランと比較するため、Run34のデータを用いた。ま た、念のため、電磁ホーン電流値の3段階の変動を含まないようイベントを選別した。

図 5.22 は各バンチごとのミューオンモニター (シリコン PIN フォトダイオード)で測定したビームのプロ ファイル中心である。黒プロット、赤プロットはそれぞれ X 方向と Y 方向について示しており、黒点線、赤 点線はスピル当たりの X 方向と Y 方向のプロファイル中心を示している。誤差棒はそれぞれの RMS を表し ている。これを見ると、Run34 ではバンチごとのばらつきは最大で±1 cm (X 方向)、±0.2 cm(Y 方向) ほどし かないのに対し、Run36 では最大で±3 cm (X 方向)、±2 cm (Y 方向) もばらついている。

このばらつきがミューオンモニターの測定によるものであるかどうか調べるため、ニュートリノ1次ビーム ラインの最下流に置かれている陽子ビームプロファイルモニター SSEM の測定結果との相関を見た (図 5.23)。



図 5.21: ホーン 1 の電流値と muon yield の相関図。1 次関数のフィット直線も一緒に描いている。3 段階の変 動に対しリニアな相関がみられる。

MRrun	Run34	Run36
1バンチ当たりの陽子数 (ビーム強度 (kW))	7.8×10 ¹² (65.1)	6.0×10 ¹² (73.7)
	2.9 時間	1.2 時間
ホーン電流値のカット	なし	ホーン 1 電流値 < 251.3 kA
		ホーン 2 電流値 < 250 kA
		ホーン 3 電流値 < 250 kA

表 5.8: バンチごとのビーム方向解析に用いたデータセット

すると、奇麗に線形に相関していることから、陽子ビームが炭素標的に到達する時点で既にバンチごとに軌 道がばらついている事がわかる。逆相関になっているが、これは定性的に次のように考えられる。陽子ビーム がビーム中心からずれて炭素標的に入射すると、生成されたπ中間子はホーンがつくる磁場によって曲げら れ、入射した位置とは軸対称の位置に飛び出す。そのため、ミューオンモニターと SSEM のビーム中心の測 定値は逆相関になっていると考えられる。また1つのバンチをみても、Run34 ではおよそ 0.5 cm ほどのばら つきであるのに対し、Run36 ではおよそ 2 cm もばらついている。後でも述べるが、Run36 で得られたミュー オンモニターの1 スピル当たりの方向決定精度は 0.21 cm 以下であり、このばらつきがミューオンモニター の測定分解能によるものとは考えにくい。



バンチごとの方向のばらつきの原因はまだ良く分かっておらず、現在調査中である。

図 5.22: Run34、Run36 におけるバンチごとのプロファイル中心。黒プロットは X 方向のプロファイル中心 を示し、赤プロットは Y 方向のプロファイル中心を示す。Run36 の方がバンチごとのプロファイル中心のば らつきは大きい。尚、黒 (赤)の点線はそれぞれスピルで求めたときの X(Y) のプロファイル中心の平均値を 示している。

muon yield

muon yield を測定する事はニュートリノ生成量を測定する事と同義であり、したがって前の物理ランからの変化が無いか確かめるのは重要な事である。

5.9 はこの解析で用いたデータセットである。データセットとしてはまた Run34 のデータを使用した。問題を単純化するため、1 バンチ当たりの陽子数がほぼ同じデータを用いて比較を行った。今回もホーン電流値の3 段階の変動を含めないよう、イベントを選別した。

図 5.24 は Run34、Run36 における muon yield の測定値である。表 5.10 にそれぞれの分布の中心値と RMS を載せた。今回のランでは以前と比べシリコン PIN フォトダイオードで 5.4%、イオンチェンバーで 3.1% 増



図 5.23: 陽子ビームプロファイルモニター SSEM で得られたプロファイル中心とミューオンモニターで得ら れたプロファイル中心の相関。相関が見られることから、陽子ビームの軌道そのものにバンチごとのばらつ きが見えている事がわかる。

MRrun	Run34	Run36
1バンチ当たりの陽子数 (ビーム強度 (kW))	6.2×10 ¹² (50)	6.0×10 ¹² (73.7)
データ取得時間	10.8 時間	1.2 時間
ホーン電流値のカット	なし	ホーン1 電流値 < 251.3 kA
		ホーン 2 電流値 < 250 kA
		ホーン 3 電流値 < 250 kA

表 5.9: バンチごとの muon yiled の測定で用いたデータセット

表 5.10: Run34 と Run36 で得られた muon yield の比較

	シリコン PIN フォトダイオード		イオンチェンバー	
	Mean (nC/10 ¹² ppp)	RMS/Mean (%)	Mean (nC/ 10^{12} ppp)	RMS/Mean (%)
Run34	33.60	0.21	0.96	0.21
Run36	35.43	0.27	0.99	0.29
	+5.4%		+3.1%	

加している事が分かった。



(a) シリコン PIN フォトダイオードで得られた muon yield



⁽b) イオンチェンバーで得られた muon yield

図 5.24: ミューオンモニターで得られた muon yield の測定値。黒色の分布は Run34 の測定結果を示し、赤色 は Run36 の測定結果を示している。Run36 の方が muon yield の測定値は大きい。

この増加の原因について、すぐに調査を行い、少なくとも以下の理由によるものである事が分かった。

1. 較正値 (pC/ADCcount) の増加

物理ランが行われる前には常に既に 3.3.2 章で述べた CAMAC QT ジェネレータを用いたケーブル及 び読み出し回路のキャリブレーションを行っている。これにより ADC カウントから電荷量の較正値 (pC/ADCcount)を決定しているが、Run36 が行われる前の較正作業の時に使用した QT ジェネレータ の出力が弱くなっている事が分かった。それで、較正値が高くなっていた。QT の出力低下を調べると 3.2%である事がわかり、これがそのまま較正値に効いてくるはずである。したがって、これにより muon yield の測定値は以前よりも 3.2%増えてしまったと考えられる。尚、この較正値はシリコン PIN フォト ダイオードのみに適用している。イオンチェンバーは 2010a が始まる前の較正値をそのまま適用して いるので、この 3.1%の増加の影響を受けていない。これを確かめるために、シリコン PIN フォトダイ オードとイオンチェンバーで全収集電荷量の比をとり、Run34 と Run36 で比べてみた (図 5.25)。こう する事で比の増加量は較正値の増加に対応するはずである。調べると 2.8%の増加であり、これはほと んど較正値の増加分で説明できる。 2. 反射波削減の影響

シャットダウンに行われた LPF の改善により、反射波が削減した (図 5.26)。そのため、波形積分の値が 以前よりも 1.3%増えている事が分かった。

3. ペデスタルの変化

表 5.9 のデータセットを用いて、ペデスタルの変化からくる波形積分の違いを考慮した。まず最初のバ ンチが来る前の信号レベル (オフセット)と、波形積分に用いるペデスタルとの差を Run34 と Run36 の それぞれについて見たのが図 5.27 である。この図はそれぞれの Run で得られた 1 スピル当たりの波形 を示していて、オフセットの領域とペデスタルの線が示されている。これを見ると、ペデスタルとオフ セットの信号レベルがそれぞれの Run で異なっている。そこで、これらオフセットの値とペデスタル の値の平均を計算した。そして、これらの差分をそれぞれの Run について計算した結果を表 5.11 に示 す。表中の値は全て ADC count で書かれている。すると Run36 では 0.24 ADC count 分、ペデスタルが 増えている。これにより波形積分の値の増加分を計算すると、0.2%の増加に寄与することが分かった。 ペデスタルが変化した理由は、バンチ数が増え 6 バンチから 8 バンチに増えたことにより、ペデスタ ルの計算領域 (最初のバンチがくる前-最後のバンチ+20 sample) が変わってしまった事そして反射波が 減った事が考えられる。

4. 電磁ホーン電流値の違い

今回解析に使用したデータセットでは Run36 の方が全体的に Run34 に比べて約 0.5%ほどホーン電流 値が大きい。5.3.2 章で述べたように、ホーン電流値が上がると muon yield も増えてしまう。しかし、 シャットダウンにおける電源交換に伴い電流のモニター絶対精度も変わってしまった。以前の物理ラン の時に比べ 1%の不定性と考えられている。つまり、実際にホーン電流値が上がったかどうかは定かで はないため、このホーン電流値の増加に対し 1%の誤差を付ける事にする。全ホーン電流値が 1%変化す ると、muon yield は 1.8%変化する事が分かっている。今回は電流値は 0.5% ± 1% の変化なので、muon yield の増加は +0.9% ± 1.8% である。

表 5.12 にこれらの影響をまとめた。全体の影響を考慮すると 5.9%±1.8%の増加となり、今回確認された 5.4%の増加分とほぼコンシステントである。

	オフセット	ペデスタル	(ペデスタル – オフセット)
Run34	-75.99	-78.38	-2.38
Run36	-78.15	-80.29	-2.14
Run36 1	こおけるペデス	、タルの増加分	+0.24

表 5.11: Run34 と 36 のオフセットとペデスタルの違い

また、バンチごとの muon yield も同じデータセットを用いて調べたところ図 5.28 のようになった。黒プ ロットは Run34、赤プロットは Run36 の結果である。これを見ると、今回の Run36 ではバンチごとに muon yield が徐々に増加しているのがわかる。これについてはまだ未解決の段階であり、現在調査中である。



図 5.25: シリコン PIN フォトダイオード、イオンチェンバーで得られた全収集電荷量の比。左図は Run34 の測 定結果で右図は Run36 の測定結果を表している。この比の増加分が較正値の増加分に対応すると考えられる。



図 5.26: (Run34 と Run36 で見られた反射波。Run34 で見られた上向き成分の反射波は Run36 では消えている。LPF を交換に際して、インピーダンス整合用の 51Ω の抵抗を入れたため、この違いが生まれた。



図 5.27: 波形のオフセットとペデスタル。(a) は Run34 で、(b) は Run36 で得られたもの。

理由	增加分
較正値の変化	+3.2 %
反射波削減	+1.3%
ペデスタルの変化	+0.2%
ホーン電流値の違い	+0.9%±1.8%
Total	5.6%±1.8%

表 5.12: muon yield 増加の原因の内訳



図 5.28: バンチごとに muon yield。黒プロットは Run34 の測定結果を、赤プロットは Run36 の測定結果を表 している。Run36 ではバンチごとに muon yield が増加している。

ビーム強度 (kW)	105.6 (8 bunches, spill cycle = 3.2 s)
強度測定分解能(%)	0.07
方向測定分解能 (cm) (x)	0.21
(y)	0.13
陽子ビーム入射角度 RMS (mrad) (x)	0.005
(y)	0.010

表 5.13: Run36 における測定分解能

5.5.2 方向 強度測定分解能

測定分解能のチェックはミューオンモニターの安定性をチェックできるという意味で、非常に重要である。 今回の Run36 でも、5.3.1 章と同様の方法で、方向及び強度測定分解能を求めた。この方法ではホーン電流値 のふらつきも打ち消すことができるため、ホーン電流値のカットはかけていない。表 5.13 が結果である。以 前のランに引き続き十分よい測定分解能が得られている。

5.5.3 ビームの安定性

Run36 で得られたビームの安定性を図 5.29 (プロファイル中心)、図 5.30 (muon yield) に載せた。これらの 図は S/N 比がより良いシリコン PIN フォトダイオードの測定値を用いて 1 スピルごとにプロットしたもの である。また、5.2 章で述べた Good spill selection により、選別したイベントを用いている。図 5.30 の muon yield の測定結果を見ると、低い値にところどころプロットが見える。これらのイベントはビームロスのため 始めの 1、2 バンチ目しかビームが来ていないイベントに対応している。

これら測定値の平均値及び RMS を表 5.14 に示した。比較のため、Run34 の結果も載せている。5.5.1 章で 述べたように、方向の測定ではバンチごとのふらつきは Run36 では大きかったが、スピルごとのふらつきで はあまり大差はない。muon yield の測定では、測定値が 5.5%上がっているが、これは 5.5.1 章で既に述べた 理由による。また RMS/Mean の値も今回の方が大きい。これはホーン電流値が 3 段階に変動していたため、 muon yield もそれに応じて変動したためふらつきが大きくなったと考えれる。しかし、ビーム方向、強度共 に安定性は十分確保できており。物理要請である 1 mrad 以内及び 3%のフラックス変動を十分に抑えている 事がわかる。

しかし、5.5.1 章で述べたように muon yield のバンチごとの上昇の原因についてはまだ完全に理解できてい ない。この問題は早急に解決し、これまでの測定結果と今回の測定結果との不整合性を調べていく。



図 5.29: Run36 におけるミューオンモニターによるプロファイル中心の測定結果。



図 5.30: Run36 におけるミューオンモニターによる muon yield の測定結果。

表 5.14: Run34&Run36 におけるミューオンモニターによるミューオンビームの方向 · 強度の測定結果

	Profile center (cm)		muon yi	elds
MRrun	x (Mean \pm RMS)	y (Mean ± RMS)	Mean (nC/10 ¹² ppp)	RMS/Mean (%)
Run34	-0.30 ± 0.52	-2.49 ± 0.52	33.60	0.25
Run36	0.32 ± 0.46	-0.38 ± 0.52	35.45	0.77

5.6 ミューオンビームの形状

最後に、ミューオンモニターで観測しているミューオンビームの形状について述べる。現在、ミューオンモ ニターで見えるビームの形状は奇麗な軸対称ではなく、非軸対称な形状をしていることがわかった。図 5.31 に典型的なミューオンモニターで測定された1スピルあたりのビームプロファイルを載せる。これを見ると、 ビームは奇麗な軸対称ではなく、少し曲がったような非軸対称である。定量的に見るため、次のような操作 を行う。図 5.32 のように、9 チャンネル分の収量電荷量 N₁、N₂、N₃、N₄ を1スピルごとに求める。そして これらの値を用いて、非対称度 A_{top}、A_{bottom} を次のように定義する。

$$A_{top} = \frac{N_1 - N_2}{N_1 + N_2}$$

$$A_{bottom} = \frac{N_3 - N_4}{N_3 + N_4}$$
(5.4)

図 5.33 は Run36 で得られた A_{top}、A_{bottom}のスピルごとのヒストリープロットである。これは、シリコン PIN フォトダイオードの収量電荷量を用いて得られたプロットである。ビーム方向の変化や、プロファイル 幅の変化の影響とみられる変動が見られるものの、A_{top} も A_{bottom} もほぼ一定で有限な値を持っていて、それ ぞれ平均値で、

$$A_{top} = -0.0133 \pm 0.0002 \ (sys.)$$

$$A_{bottom} = 0.0075 \pm 0.0002 \ (sys.) \tag{5.5}$$

であることがわかった。ここで、系統誤差には、3.3.2 章で述べたチャンネル間の相対ゲインの不定性 0.1% (シリコン PIN フォトダイオードの場合)を考慮した。また、統計誤差は~10⁻³% 程度なので無視している。 ここで注意しなければいけない事は、プロファイル形状が軸対称であっても、ビーム方向が中心からずれれ ば $A_{top} \neq 0$ 、 $A_{bottom} \neq 0$ となる事である。そして、その場合は両者の符号は一致するはずである ($A_{top} > 0$ 、 $A_{bottom} > 0$ 又は $A_{top} < 0$ 、 $A_{bottom} < 0$)。しかし、式(5.5)をみると、系統誤差を考慮したとしても両者の符号は 一致していない。つまり、プロファイル形状が軸対称ではあり得ない結果となっている。この結果に合う様な 形状を考えた時、一つの可能性として図 5.34 のように、細長い楕円が傾いている事が考えられる。ミューオ ンビームでこのような形状が観測されているので、ニュートリノビームでも同様な形状をとっている可能性 が高い。次の章では、ニュートリノビームの形状を評価するため、INGRID shoulder module で Run36 のデー タ解析を行ったのでそれを述べる。また、シミュレーションにより、ビームの形状を変え、SK のニュートリ ノフラックスがどう変化するかを調べたので、それについても述べる。





図 5.31: 1 スピルの測定で得られたミューオンビームの プロファイル形状。ビームは軸対称の形をしていない。

図 5.32: N1、N2、N3、N4の定義





図 5.34: 想定されるニュートリノビームの形状。楕円 が傾いたような形をしていると予想される。

図 5.33: Run36 で得られた A_{top} と A_{bottom} のヒストリー プロット

第6章 ニュートリノビーム形状からくる系統誤差 の評価

5.6 章で述べたように、ミューオンモニターで観測されているビーム形状は非軸対称の形をしている。この 章では、こういった影響がニュートリノビームに表れているのかを確認するため、INGRID shoulder module による Run36 のデータ解析をした。そして、シミュレーションを用いて、ニュートリノビームを人工的に非 軸対称の形にし、これが SK におけるニュートリノフラックスにどう影響を及ぼすか検証したのでそれを述 べる。

6.1 INGRID shoulder module を用いた 2010b データ解析

ここでは、2010b (Run36) のビームデータ解析を行い、ビーム形状を評価した。その前に、まず INGRID shoulder module のインストール後のチェックについて報告する。続いて、ニュートリノイベントを求めるに あたり、どのようにセレクションをするか述べた後で、module14、15 でデータ解析の結果を述べる。そして、 ビームの形状を評価するために非対称度を導入し、Run36 でこの値がどうであったかを述べる。

6.1.1 インストール後のチャンネルチェック

2010 年 10 月 16 日、17 日に INGRID shoulder module の前置検出器ホールへのインストールを終えた。イ ンストール前で module14、15 の全 1232 チャンネルが問題なく動いていた。インストール後の状態を確か めるため、インストール後に MPPC のノイズによる ADC 分布を見てチャンネルの生存をチェックした。図 6.1 はインストール後のあるチャンネルの MPPC の ADC 分布である。(a) は奇麗に 1 p.e.、2 p.e. の信号が確 認できるが、(b) はそういったものが見えていない。module14 では全 616 チャンネルの生存を確認したが、 module15 には図 6.1(b) のような分布をもつチャンネルが 2 つ見つかった。ケーブル損傷によるものと考えて いるが、shoulder module は 2.5 m ほどの鉄の足場の上にあるため、ケーブルの交換作業は難しいと判断した。 そのため、module15 のその 2 つのチャンネルに関してはデッドチャンネルとして解析する。

6.1.2 ニュートリノイベントセレクション

図 6.2 に典型的なニュートリノイベントの模式図を示す。INGRID に到達したニュートリノはモジュール内の鉄と反応し、生成した荷電粒子がシンチレータでエネルギーを落とす。この時、トラッキングプレーンのシンチレータについては 2.5 p.e. 以上、VETO プレーンのシンチレータについては 3.5 p.e. 以上の信号をヒッ



図 6.1: インストール後の MPPC ノイズの ADC 分布。(a) は 1 p.e、2 p.e の信号が見えているが (b) はケーブ ル損傷と考えられ、1 p.e.、2 p.e. の信号が見えていない。



図 6.2: INGRID モジュール内で起こる典型的なニュートリノ反応。ここでは荷電カレント準弾性散乱 (CC-QE) の反応を示した。生成した陽子はほとんど鉄で止まってしまうが、µ 粒子は長い飛跡を残し、シンチレータ にエネルギーを落とす。

トと定義し、それ以下の信号はノイズとしてカットする。

INGRID shoulder module のニュートリノイベント再構成の方法は INGRID と同じ方法を採択する。ヒット した信号を用いて、以下のようにしてニュートリノイベントのセレクションを行った。

1. Time clustering

INGRID の全トラッキングプレーンのシンチレータ内で 100 ns 以内に 3 つのヒットがあり、かつこれ ら時間平均からの残差が 50 ns 以内であるイベントを選択する。これにより、アクシデンタルなノイズ ヒット (以降、アクシデンタルヒットという)を除去する。

2. Number of active planes selection

あるトラッキングプレーンの X 方向のシンチレータ層と Y 方向のシンチレータ層からヒットがあった 場合、そのプレーンをアクティブプレーンと定義する。アクシデンタルヒットの寄与を除去するため、 アクティブプレーン数が 2 枚より多い事を要求する。図 6.3(a) はアクティブプレーン数分布を表したも のである。8 枚以上でアクティブプレーン数が増加するのは、ニュートリノが前置検出器ホールの壁で 反応して生じた外からの μ 粒子 (Sand muon) がモジュールを突き抜けたり、長い飛跡を残して止まるイ ベントが増えるためである。

3. PE/(number of active planes) selection

Number of active planes selection を満たしたアクティブプレーンの1レイヤー当たりの光量をチェック する。シミュレーションの結果より、これが6.5 p.e より多ければアクシデンタルヒットが起因のイベン トはニュートリノイベントに対して数%程度に抑えられる事が分かっている。したがって、6.5 p.e. よ り多ければ次の Tracking に移る。(図 6.3(b))

4. Tracking

上記のセレクションで生き残ったヒットイベントに対し、Tracking を行う。トラックの再構成は X-Z 平面、Y-Z 平面に対してそれぞれ独立に行う。ヒットがあったプレーンの内、最下流のプレーンにある ヒットポイントをトラックの終端とする。続いて上流のプレーンにヒットがあるかどうか順々と探し ていき、最後に最小2乗法によりこれらヒットチャンネルに対してフィットをする。最下流プレーンに ヒットチャンネルが2つ以上ある場合、それぞれの組み合わせについて、上記のアルゴリズムを用いて トラックを再構成する。

5. Track matching

Tracking を行った後、X-Z 平面と Y-Z 平面の両方の結果がコンシステントなものかどうかを確かめる ため、Track matching selection を行う。X-Z 平面、Y-Z 平面のトラックの始端 (最上流にあるプレーン にあるヒット: 以下 vertex と呼ぶ)のZ 方向の位置の差が2 プレーン以下であるか確認し、そうでなけ ればこのイベントを除去する。図 6.3(c) は Track matching のため、2 つの平面の vertex のZ 座標の差を 見たものである。

6. Beam timing cut

Track matching が終わったら、そのイベントがビームタイミングと合っているかどうかを確かめる。 ニュートリノがくるタイミングを各バンチごとに計算し、その予測値からの実際のニュートリノイベン トのタイミングのずれが 100 ns 以内であることを要求する。(図 6.3(d))

7. Upstream VETO cut & Fiducial volume cut

最後に、これまでに生き残ったイベントに対し、次の2つのセレクションを用いる。まず、構成したト ラックを周りの VETO プレーンまで外挿させる。そして、上流の VETO にヒットがあった場合、VETO カットとして除去する (図 6.4)。これにより、たまたま Beam timing に合った宇宙線、隣のモジュール でニュートリノが反応して出てきた μ 粒子、そして Sand muon によるバックグラウンドな粒子を除去 する。これが Upstream VETO cut である。しかしこの cut でも除去できないようなバックグラウンドの イベントがある。それは VETO の不感効率 (Inefficiency) によるものや VETO プレーンの隙間からくる バックグランドな粒子、そしてビーム軸方向に真っすぐに飛んでくるような Sand muon である。よっ て、図 6.5 のように Fiducial volume を定義し、vertex が中にある事を要求する事で、Upstream VETO cut で除去できない様なバックグラウンドなイベントも除去する。尚、Fiducial volume は 2 番目から 8 番目のトラッキングプレーンで、モジュール中心から ±50 cm の直方体としている。

こうして生き残ったトラックの vertex の数は INGRID のモジュール内で反応したニュートリノの数に対応す る。したがって vertex 数をニュートリノイベント数とする。図 6.6 はこのセレクションで生き残ったニュー トリノイベントのイベントディスプレイである。また、表 6.1 に、INGRID で得られた 2010a データに対す るイベントセレクションの結果と、シミュレーションで見積もったセレクション効率を載せた。

表 6.1: INGRID で得られた 2010a データに対するイベントセレクションとシミュレーションによるセレクショ ン効率の結果

Event selection	Data	selection efficiency (Simulation)
# of active plane > 2	1906146	
PE / active layers > 6.5	1906078	1.00
Tracking	1804786	0.93
Track matching	1749548	0.97
Beam timing	1747181	1.00
Upstream VETO cut	745912	0.42
Vertex in fiducial	493813	0.66

6.1.3 データ解析

2010 年 11 月から 12 月の約 1ヶ月に渡って行われた Run36 のデータを用い、ニュートリノイベント数の測 定を行った。このデータ解析の目的は module14 と module15 でニュートリノイベントの総数を出し、ビーム プロファイルの形状が非軸対称かどうかを調べる事である。

ニュートリノイベントの観測

図 6.7 は Run36 において、INGRID shoulde module で観測されたニュートリノイベントである。これにより、shoulder module でもニュートリノの検出を確認した。



図 6.3: ニュートリノイベントセレクション。(a)Number of active plane selection: アクティブプレーン数が2枚 より多い事を要求する。(b)PE/(number of active plane) selection: アクティブプレーンの1レイヤー当たりの光 量が 6.5 p.e. より多い事を要求する。(c)Track matching selection: X-Z 平面と Y-Z 平面の vertex の差をとり、2 プレーン以下であることを要求する。(d)Beam timing cut: イベントタイミングと予想したビームタイミング との差をとり、±100 ns 以内であることを要求する。



図 6.4: Upstream VETO cut selection。一見ニュートリ ノイベント反応に見えるが、Side view を見ると、ト ラックを VETO プレーンに外挿させるとそこにヒット チャンネルがある。こういった粒子は宇宙線か、隣のモ ジュールで出てきた荷電粒子、及び Sand muon といっ たバックグラウンドな粒子である。こういったイベン トは除去する。



図 6.5: Fiducial volume の定義



図 6.6: ニュートリノイベントセレクションで得られたニュートリノイベント。一本のトラックが見え、CC-QE 反応により、µ粒子が残した飛跡と考えられる。



図 6.7: INGRID shoulder module で観測したニュートリノイベント。(a) は module14、(b) は module15 による 測定。どちらも典型的な CC-QE 反応によるものと考えられる。

ニュートリノ検出の安定性

続いて Run36 で得られた shoulder module のニュートリノ検出の安定性について述べる。尚、以下得られた結果は全て 5.2 章で述べた Good spill selection により選ばれたデータを用いている。

図 6.8 は 1 日ごとに得られたニュートリノイベントを POT 数で規格化したもの、イベントレートをプロットしたものである。誤差棒は統計誤差を表している。これに対し、 χ^2 検定により module14、15 のイベントレート平均値、及び Reduced χ^2 の値を計算した結果を表 6.2 に表す。これから、イベントレートは module14、15 でそれぞれ 9.20 ± 0.048 /10¹⁶ POT、9.05 ± 0.047 /10¹⁶ POT であった。また Reduced χ^2 の値は module14、15 でそれぞれ 15.23/31、45.9/31 である。module15 については module14 よりも相対的にイベントレートの変動が大きいが、1 日おきのイベントレートは両モジュールで安定している。

図 6.9 はトリガー (ADC ゲートのスタートタイム) からのニュートリノイベントのタイミングをプロット したものである。奇麗な 8 つのピークが見えており、これはビームの 8 バンチ構造に対応している。分布の ピーク高で差が見られるが、これは分布幅が大きくなったためである。表 6.3 には Run36 で得られたバンチ ごとのニュートリノイベント数とそのイベントレートを載せた。これより、バンチごとのイベントレートの ばらつきは最大で ±2.6% (module14)、±5.9% (module15) の範囲で安定している。イベントタイミングの分布 幅が大きくなった原因は元々の陽子ビームのバンチタイミングのふらつきが大きくなったためと考えられる。 図 6.10 に Run36 において、CT5 で計測した陽子ビームのバンチタイミングを示す。また、表 6.4 にはこれら バンチタイミングの RMS を示した。これを見ると、4,5,6,7 バンチ目で比較的 RMS が大きい事がわかる。そ のため、分布幅が大きくなっているものの、バンチごとに安定してニュートリノを検出している事がわかる。





図 6.8: INGRID shoulder module で観測されたイベントレート。(a) は module14、(b) は module15 による測定 結果。赤いラインはフィット直線を表す。

表 6.2: 1 日おきのイベントレートの平均値と Reduced χ^2

	Average (/10 ¹⁶ POT)	Reduced χ^2
Module14	$9.20 \pm 0.048(stat.)$	15.23/31
Module15	$9.05 \pm 0.047(stat.)$	45.90/31



図 6.9: INGRID shoulder module で観測されたイベントタイミング。(a) は module14、(b) は module15 による 測定結果。

		mo	dule14	module 15		
Bunch	POT(×10 ¹⁸)	Total events	Event rate (/10 ¹⁶ POT)	Total events	Event rate(/10 ¹⁶ POT)	
1	4.99	4469	8.96	4588	9.19	
2	5.00	4666	9.33	4489	8.98	
3	5.10	4703	9.22	4607	9.03	
4	5.08	4672	9.20	4359	8.51	
5	5.10	4766	9.34	4736	9.29	
6	5.11	4689	9.18	4522	8.85	
7	5.13	4701	9.16	4728	9.22	
8	5.11	4715	9.23	4755	9.31	
Total	40.6	37381 ±186 (stat.)		36784 ±184 (stat.)		

表 6.3: INGRID shoulder module で測定したニュートリノイベント

表 6.4: CT5 で計測した陽子ビームの各バンチごとのタイミングのふらつき

Bunch	1	2	3	4	5	6	7	8
RMS (ns)	10.1	10.7	12.6	15.1	19.1	15.2	16.5	13.5


図 6.10: CT5 で計測した陽子ビームのバンチタイミング。

ニュートリノビームの非軸対称性

ニュートリノビームの形状を評価をするため、式 (5.5) で定義した非対称度 A を shoulder module にも適用 する。

$$A = \frac{N_{14} - N_{15}}{N_{14} + N_{15}} \tag{6.1}$$

ここで、 N_{14} 、 N_{15} はそれぞれ module14、15 で測定したニュートリノイベント数である。 表 6.3 より Run36 で得られた module14、15 のニュートリノイベント数はそれぞれ 37381±186(*stat*)、36784±184(*stat*) となった。今、これらに与える系統誤差を考察する。module14 におけるニュートリノイベントの方が module15 よりも 1.6%±0.8% (*stat.*) 大きい事が分かった。その結果、非対称度は式 (6.2) のようになった。

$$A = 0.0080 \pm 0.0037 \, (stat.) \tag{6.2}$$

ここでこの系統誤差を見積もるため、まずは module14、15 で測定されたニュートリノイベント数の比(<u>Nis</u>) に対する系統誤差を考えていく事にする。これを用い、最終的に非対称度 A の系統誤差を見積もる。

現在 INGRID の解析ではモジュールごとの鉄質量の違いによりニュートリノイベント数の補正をかけているが、shoulder module ではまだ鉄質量を計測していないので補正をかけていない。したがって鉄質量の違いからくる系統誤差を次のようにして与える。INGRID はある 1 つのモジュールの鉄質量をリファレンスとして、これに対する質量の違いからくるニュートリノ反応数の違いを補正値としている。この補正値はモジュールごとに異なり、最大で | - 1.07% | = 1.07% の補正値をつけている。したがって、この Quadratic sum、

$$\sqrt{(1.07\%)^2 + (1.07\%)^2} = 1.51\% \tag{6.3}$$

より、-1.51%~+1.51%を全幅とした時の1σ、

$$1.51\% \times \frac{2}{\sqrt{12}} = 0.87\% \tag{6.4}$$

を系統誤差として $\frac{N_{15}}{N_{14}}$ に与えることにする。

INGRID の解析では MPPC のアクシデンタルノイズヒットによって、ニュートリノイベントの再構成を失 敗するケースも考慮している。実際のニュートリノイベント数を算出するため、次の事を行っている。まず、 シミュレーションによってノイズヒットがある場合とない場合でニュートリノイベント数を比較する。この 操作をモジュールごとに行い、ニュートリノイベント数の違いを補正値として、測定値に適用している。こ の補正値はモジュールごとに違っていて、最小で +1.48%、最大で +5.01% である。shoulder module につい て、まだこのノイズヒットによる補正値を見積もれていない。したがって、INGRID に対する補正値の最大 値と最小値の比、

$$\frac{100+5.01}{100+1.48} \equiv +3.57\% \qquad \qquad \frac{100+1.48}{100+5.01} \equiv -3.34\%$$

の内大きい方 (3.57%) をとり、-3.57% ~ +3.57% を全幅とした 1σ、

$$3.57\% \times \frac{2}{\sqrt{12}} = 2.06\% \tag{6.5}$$

を系統誤差として $\frac{N_{15}}{N_{14}}$ に与えることにする。

ニュートリノイベントセレクション時に生じる系統誤差についても、INGRIDの解析で見積もられている。 この系統誤差はシミュレーションによって求めている。まずシミュレーション上でイベントセレクションの条件を変えてニュートリノイベント数を算出する。実データでも同様に条件を変えていき、最後にシミュレーションとデータの結果を比較する。このときのセレクション効率の違いを系統誤差としている。この INGRIDの結果を用いて $\frac{N_{15}}{N_{14}}$ に対する系統誤差を算出すると、表 6.5の様になった。尚、この表内では上に述べた MPPCアクシデンタルノイズヒットの補正値の不定性 (=0.7%) も考慮した。これから、 $\frac{N_{15}}{N_{14}}$ に対するイベントセレクションからくる系統誤差は 3.77%である。

最後に、鉄の質量の測定は 0.1%の精度で行われている。したがって、 $\frac{N_{15}}{N_{14}}$ に対してはこの Quadratic sum

$$\sqrt{(0.1\%)^2 + (0.1\%)^2} = 0.14\%$$

を系統誤差とする。

 $\frac{N_{15}}{N_{14}}$ に対する系統誤差を表 6.6 にまとめた。これを元に、系統誤差を考慮して非対称度 A を求めると式 (6.6) となった。

$$A = 0.0080 \pm 0.0037 \, (stat.) \pm 0.0219 \, (sys.) \tag{6.6}$$

今後の課題

Run36 で得られた shoulder module の結果を用いて、非対称度 A を式 (6.6) のように求めた。これより、系統誤差が大きく、現状ではビームの非軸対称は見えない。今後統計量を増やし、統計誤差は小さくなると予

Error source	Error size
Accidental MPPC noise	0.99%
Beam-related background (Sand muon)	0.28 %
Fiducial volume	1.56%
Hit efficiency	2.55%
Tracking efficiency	1.98%
Track matching selection	0.57%
Non beam-related background (Cosmic ray)	<0.1%
p.e./active layer selection	<0.1%
Beam timing selection	<0.1%
Total	3.77%

表 6.5: ニュートリノイベントのセレクションからくる $\frac{N_{15}}{N_{14}}$ の系統誤差

表 6.6: $\frac{N_{15}}{N_{14}}$ に対する系統誤差のまとめ

Error source	Error size
鉄質量の違い	0.87%
ノイズヒット	2.06%
ニュートリノイベントのセレクション効率	3.77%
鉄質量の測定精度	0.14%
Total	4.39%

想される。したがって、非軸対称の測定では系統誤差を小さく抑えくことが必要である。今後の課題として 以下の事が挙げられる。

- 鉄質量とノイズヒットの違いによる系統誤差
 既に述べたように、ニュートリノイベント数は鉄質量、またノイズヒットによって補正されるべき値である。今回はこれらの補正値を見積もっていないため、系統誤差として与えた。もしこれらの補正ができたのであれば、^{N15} に対する鉄質量とノイズヒットの違いからくる系統誤差は、それぞれ 0.14%、0.99%まで抑えれると期待される。
- データとシミューレーションの違いからくる系統誤差
 現状では表 6.6 にある通り、ニュートリノイベントのセレクション効率の系統誤差が最も大きい。しかし、このセレクション効率の系統誤差の多くはデータとシミュレーションの違いで見積もられたもので、モジュールごとのニュートリノイベント数に与えられるものである。これに対し、shoulder moduleの非対称度測定はニュートリノイベント数の比から求めているので、比を取る事で打ち消し合う系統誤差も含まれているはずである。したがって、今後はさらに非対称度 A の系統誤差を小さく抑えれる可能性がある。

6.2 非軸対称なビーム形状からくる SK におけるニュートリノフラックス (Φ_{SK})の系統誤差

6.1 章では、Run36 のデータ解析によってビーム形状の非軸対称を評価したが、ここではシミュレーション によってビーム形状を変え、これから SK のニュートリノフラックス (Φ_{SK}) がどう変化するかを考察する。

現在ターゲットの直前に置かれている OTR の測定では、図 6.11 のようにビームの非軸対称な形状は見え ていない。したがってターゲットから下流で、何かビームを非軸対称の形にしている要因があると考えられ る。しかし、ここでは極端なケースとして、シミュレーション上で Re-weighting という方法を用いて、あら かじめ陽子ビームを非軸対称な形にした。こうしてニュートリノビームの形状を変え、Φ_{SK} の変化を考察す る。そして、この変化量を「系統誤差」として扱う事にする。尚、シミュレーションには T2K ニュートリノ ビームシミュレーション「JNUBEAM」を用いた。(JNUBEAM については付録 C.1 を参照。)

6.2.1 陽子ビームの Re-weighting

JNUBEAM では通常ニュートリノフラックスはニュートリノビーム形状が軸対称であると仮定して見積も る。そこで、以下に述べる Re-weighting という方法を用いた。まず、JNUBEAM にインプットされる陽子ビー ムの形状は軸対称な 2 次元ガウス分布 (式 (6.7)) である。これに対し、式 (6.8) のように、楕円が傾いたよう な非軸対称な形の 2 次元ガウス分布へと変化させる。

$$\frac{1}{N_1} \exp(-\frac{(x-X_0)^2}{2\sigma_X^2} - \frac{(y-Y_0)^2}{2\sigma_Y^2})$$
(6.7)



図 6.11: OTR で測定された陽子ビームのプロファイル。ビーム強度 70 kW で得られたもの。

$$\rightarrow \frac{1}{N_2} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma_x^2} - \frac{\rho(x-x_0)(y-y_0)}{\sigma_x \sigma_y} + \frac{(y-y_0)^2}{2\sigma_y^2}\right)\right)$$
(6.8)

ここで、 X_0 、 Y_0 (x_0 、 y_0) はそれぞれ JNUBEAM にインプットされる X 方向、Y 方向の陽子ビームのプロファイル中心、 σ_X 、 σ_Y (σ_x 、 σ_y) はそれぞれ X 方向、Y 方向における陽子ビームのプロファイル幅である。 また N(N') は共に規格化定数を表し、そして ρ は以下の式で定義される相関パラメータである。

$$\rho = \frac{\operatorname{cov}(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\sigma_x \sigma_y} \tag{6.9}$$

式 (6.7) に対する式 (6.8) の比を Re-weighting factor とし、元々の陽子ビームの分布 (F(x, y)) にこの Re-weighting factor をかける事で、非軸対称の 2 次元ガウス分布 ($F'(x, y, \rho)$) を求める。

$$F'(x, y, \rho) = \text{Reweighting-factor}(x, y, \rho) \times F(x, y)$$
 (6.10)

JNUBEAM にインプットされる陽子ビームのパラメータは既定値の表 6.7 のようになっている。 x_0, y_0 は それぞれ JNUBEAM にインプットされる陽子ビームプロファイル中心、 σ_x, σ_y はプロファイル幅である。こ れに対し Re-weigthing によって相関パラメータである ρ を変化させ、INGRID shoulder module でニュートリ ノイベントがどう変わるかをみた。図 6.12(a)(b) は Run36 のビームパラメータに合わせ、 ρ を 0、0.2 と変化 させたときの陽子ビームのプロファイルを見たものである。図 6.12(c) はこれらの比をとったもので、相関の 効果が表れていることがわかる。また、この Re-weighting によって、楕円が傾いたようなビーム形状を再現 できているかをチェックするため、 ρ を変化させた時のミューオンモニターにおける非対称度 A_{top}, A_{bottom} (式 (5.4)) を確認した。図 6.13 がその結果である。尚、図中の誤差棒は統計誤差を表す。これを見ると、 ρ に対し て $A_{top}(A_{bottom})$ は逆相関 (正相関) がみられる。つまり Re-weighting でビームの回転は上手く再現できている 事がわかる。

表 6.7: JNUBEAM にインプットする陽子ビームのパラメータ

	x ₀ (mm)	y ₀ (mm)	σ_x (mm)	σ_y (mm)
規定値	0.37	0.84	0.4273	0.4167



図 6.12: JNUBEAM にインプットする陽子ビームのプロファイル形状。相関パラメータ ρ を0(a)、0.2(b)と変えていった時のもの。(c) は (a) に対する (b) の比をとったもので、相関の効果が表れているのが分かる。



図 6.13: ρ に対する A_{bottom} 、 A_{top} の関係。 ρ と A_{top} では負の相関があるの対し、 A_{bottom} では正の相関が見られる。

6.2.2 Φ_{SK}の不定性

図 6.14 は相関パラメータ ρ を-0.8~0.8 と 0.2 刻みで変えていった時の Φ_{SK} を表す。これらフラックスは全 て POT 数が 10^{21} の場合を想定している。各 ρ について得られた Φ_{SK} について、 $\rho = 0$ に対する比をとったも のが図 6.15 である。尚、図中の誤差棒は統計誤差を表している。これを見ると、ρを増やすに従い、ニュー トリノエネルギー 0.8-1.5 GeV 付近のフラックスが大きく変化するのがわかる。振動確率が最大となるニュー トリピークエネルギー (0.5-0.7 GeV 付近) におけるフラックス変化量と、フラックス変化量の最大値を表 6.8



(d) $\rho = 0, \pm 0.8$

(c) $\rho = 0, \pm 0.6$

図 6.14: 様々な ρ に対する Φ_{SK}



図 6.15: $\rho = 0$ の Φ_{SK} との比。 ρ の大きさを大きくしていくと 0.8-1.5 GeV 付近のフラックスが大きく変化していく。

ρ	Change at Peak (0.5-0.7 GeV)	Maximum Change (<3 GeV)
+0.1	0.1%	0.5%
-0.1	0.1%	0.5%
+0.2	0.2%	1.0%
-0.2	0.3%	1.0%
+0.3	0.2%	1.6%
-0.3	0.6%	1.5%
+0.4	0.4%	2.2%
-0.4	0.8%	2.0%
+0.5	0.7%	2.9%
-0.5	1.1%	2.6%
+0.6	1.0%	3.6%
-0.6	1.4%	3.2%
+0.7	1.2%	4.2%
-0.7	1.8%	4.2%
+0.8	1.5%	5.0%
-0.8	2.3%	5.8%
+0.9	1.9%	6.1%
-0.9	2.8%	9.5%

表 6.8: 様々な ρ に対する Φ_{SK} の変化

まとめ

 ρ を0から大きく変化させると、特に ρ = -0.9 においては、SK におけるニュートリノエネルギーのピー ク付近のフラックスが2.8%も変化している。つまりSK におけるニュートリノエネルギーのピーク付近のフ ラックスに2.8%の不定性を与えている。これはビーム方向を1 mrad 間違えた場合と同程度 (~3%)の不定性 であり、T2K が定めている許容値にほとんど等しい。この不定性を抑えるためにも、shoulder module によっ てビームの非軸対称性を正しく測定する事が必要である。

6.3 シミュレーションを用いたビーム形状評価

6.3.1 シミュレーションを用いた INGRID sholder module におけるビーム形状評価

ここでは、シミュレーションにより、ρ を変えていったときの shoulder module における非対称度 (式 (6.1)) を求めた。シミュレーションには T2K ニュートリノビームシミュレーション「JNUBEAM」と物質とニュー トリノとの反応シミュレーション「NEUT [12]」を用いている。(付録 C.2 を参照。) そしてニュートリノイベ ントを算出するために、以下の事を行った。

まず JNUBEAM によって、INGRID shoulder module の位置にニュートリノエネルギーを関数としたフラッ クスを求める。続いて、NEUT によってニュートリノ反応数を算出する。そして、最後に GEANT4 [11] に よって作られた INGRID 検出器シミュレーションを用いる。このシミュレーションにより得られた検出効率 (図 6.16) を反応数に対し適用する事で、shoulder module におけるニュートリノイベントイベント数を求める 事ができる。この過程を式 (6.11) にまとめた。

以下比較のため、INGRID 水平モジュールの module1、5 (図 6.17) で得られたニュートリノイベント数を用いて新たに次の非対称度を定義する。

$$A_{INGRID} = \frac{N_1 - N_5}{N_1 + N_5} \tag{6.12}$$

そして、陽子ビームの Re-weighting によって ρ を次々と変えていき、非対称度を求めたのが図 6.18 である。 黒い三角が式 (6.1) で求めた非対称度 A を、赤い三角が式 (6.12) で求めた非対称度 A_{INGRID} を表す。誤差棒に は統計誤差と、シミューレーションで求めた検出効率の誤差の両方を考慮している。理想としては ρ を変化 させても、非対称度 A_{INGRID} は変化せず一定の値をとると予想される。なぜなら、module1、5 はビーム軸か らみて対角線上の位置にあるため、ビーム形状が回転しても、ニュートリノイベント数は共に同じ分だけ変 化すると考えられるからである。しかし、これを見ると、 A_{INGRID} は $\rho < 0$ まではあまり変化していないが、 $\rho > 0$ から急激に変化している。その一方で、shoulder で得られた非対称度 A は $\rho > 0$ からはあまり変化して



図 6.16: INGRID 検出器シミュレーションで得られた検出効率

いない。シミュレーションの結果を信じるのであれば、 $\rho < 0$ では shoulder module がビームの非軸対称に感度があるが、 $\rho > 0$ では INGRID module1、5の方が感度があるということになる。



図 6.17: INGRID module1、5の位置



図 6.18: $\rho \geq A(\vec{x}(6.1))$ 、及び $\rho \geq A_{INGRID}(\vec{x}(6.12))$ の 関係。黒い三角がAを表し、赤い三角が A_{INGRID} を表 す。 $\rho < 0$ ではAはビームの非軸対称に対して感度が あるが、 $\rho > 0$ では A_{INGRID} の方が感度がある。

6.3.2 データとシミュレーションの比較

最後に Run36 で得られたデータの結果とシミュレーションの比較を行った。具体的にはシミュレーション の結果を用い、shoulder module とミューオンモニターの両方のデータを使って ρ を求めた。今まではシミュ レーションで用いる陽子ビームのパラメータには JNUBEAM の既定値を用いていたが、今回は陽子ビームプ ロファイルモニター SSEM による、Run36 の測定結果 (表 6.9) を用いる。具体的には平均値を用いる事にし、 これらを JNUBEAM にインプットする。

表 6.9: データとシミュレーションとの比較の際の陽子ビームのパラメータ

	x ₀ (mm)	y ₀ (mm)	σ_x (mm)	σ_y (mm)
Run36 (平均值)	-0.16	0.11	0.402	0.406

続いて、この陽子ビームに対して、Re-weighting を行い、ビームを非軸対称の形にする。 ρ を-0.8 から 0.2 刻みに変えていったときの、shoulder module における非対称度 *A* を見積もったのが図 6.19 である。ここで 比較のために、INGRID module1、5 における非対称度 *A*_{INGRID} も一緒に載せている。用いている陽子ビームのパラメータは少し違うものの、 ρ に対する非対称度の傾向は図 6.18 と同じである。



図 6.19: 表 6.9 の陽子ビームパラメータを用いたとき 図 6.20: 測定値 (*A* = 0.0080) 付近の ρ と *A* の関係。1 の ρ と *A*、及び *A*_{INGRID} の関係 次直線でフィットを行った。

Run36 で得られた shoulder module の結果によると、ビームの非対称度は

$$A = 0.0080 \pm 0.0037 \, (stat.) \pm 0.0219 \, (sys.) \tag{6.13}$$

である。これから ρ の値を逆算してみる。図 6.19 で測定値付近 (A = 0.0080) における領域を取り上げ、これ が線形な領域なので、1 次関数を用いてフィットしたのが図 6.20 である。その結果を表 6.10 にまとめる。こ のフィットパラメータを用い、 ρ を求めると式 (6.14) のようになった。

$$\rho = -0.74 \pm 0.17 \,(stat.) \pm 0.57 \,(sys.) \tag{6.14}$$

続いて、ミューオンモニターとシミューレーションの比較を試みる。図 6.21 は、表 6.9 に記した陽子ビー ムのパラメータを用いて求めた、各 ρ に対するミューオンモニターにおける非対称度 A_{top}、A_{bottom} である。 線形な応答がみられたので、これに対し、1 次直線によるフィットを行った。表 6.11 に、このフィット結果を 載せた。

表 6.10: ρ と Α のプロットを 1 次関数でフィットした結果

Fitting function: $A = a\rho + b$			
a b Reduced			
-0.03954 ± 0.00525	-0.02121 ± 0.00410	0.4828 / 4	

表 6.11: $\rho \ge A_{top}$ 、 $\rho \ge A_{bottom}$ のプロットをそれぞれ 1 次関数でフィットした結果

Fitting function: $A = a\rho + b$			
	а	b	Reduced χ^2
A_{top}	-0.01778 ± 0.00170	0.00186 ± 0.00087	0.7732/7
A_{bottom}	0.01526 ± 0.00123	0.00224 ± 0.00063	1.092/7

続いて、データ結果を求める。まず、図 6.22 のように Run36 において、ミューオンモニターで得られた ビームプロファイルを蓄積させる。蓄積したプロファイルに対し、式 (5.4) で定義した非対称度 A_{bottom}、A_{top} をそれぞれ求める。すると、これらの値はそれぞれ、

$$A_{top} = -0.0133 \pm 0.0002 \,(sys.) \tag{6.15}$$

$$A_{bottom} = 0.0075 \pm 0.0002 \,(sys.) \tag{6.16}$$

となった。ここで、3.3.2 章で述べたチャンネル間の相対ゲインの不定性 0.1% (シリコン PIN フォトダイオー ドの場合) からくる系統誤差を考慮した。また、統計誤差は ~ 10⁻³% 程度なので無視している。



図 6.21: $\rho \ge A_{top}(\mathbf{a})$ 、及び $\rho \ge A_{bottom}(\mathbf{b})$ の関係。それぞれ 1 次直線でフィットを行った。

以上より、シミュレーションで求めた表 6.11 を用い、データより得られた Atop、Abottom の両方を用いて p



図 6.22: Run36 で蓄積したミューオンビームのプロファイル

を求めると、それぞれ次の様になった。

$$A_{top}: \rho = 0.85 \pm 0.10 \,(sys.) \tag{6.17}$$

$$A_{bottom} : \rho = 0.34 \pm 0.05 \, (sys.) \tag{6.18}$$

まとめ

シミュレーションを用いて、shoulder module、及びミューオンモニターで独立に ρ を求めた。その結果、

Shoulder module (A) :
$$\rho = -0.74 \pm 0.17 (stat.) \pm 0.57 (sys.)$$
 (6.19)

Muon monitor
$$(A_{top})$$
 : $\rho = 0.85 \pm 0.10$ (sys.) (6.20)

$$(A_{bottom}): \rho = 0.34 \pm 0.05 \,(sys.) \tag{6.21}$$

となった。どの *ρ* も有意に異なっている。したがって今回のシミュレーション結果はデータを再現していない事が分かった。

今後の課題

6.2.2 章で述べたように、ビームを非軸対称の形にしていった時に、ρ = -0.9 においては SK におけるニュー トリノのピークエネルギーの不定性は 2.8% であり、T2K で定めた許容値と同程度のエラーサイズである。し かし、現状のシミュレーションは次の課題を残している。

1. シミュレーションで非軸対称度と ρ の関係 (図 6.18、6.19) を求めたとろ、shoulder module の測定では ビームの非軸対称に感度を持たない領域 ($\rho > 0$) がある事が分かった。その一方で、INGRID module1、 5 による測定ではこの ρ の領域では感度を持っている。 シミュレーションがデータを再現しているかを確かめるため、shoulder module とミューオンモニター の両方の測定結果より、それぞれ独立にρを求めた。その結果、シミュレーションはデータを再現して いない事が分かった。

これら2つの課題を克服するために、今後は次の事を行う。まず、JNUBEAM にインプットする陽子ビームのパラメータを変えていき、非対称度がρに対してどう変化していくかを確認する等して、今回のシミュレーションの結果を理解していく必要がある。またシミュレーションについては、今回行った Re-weighting とは別の方法でもビームの非軸対称を再現できる。それは電磁ホーン磁場の非軸対称性にする事である。こうする事で再びデータとシミュレーションの比較を行っていく。この比較を行う上でも、shoulder module の非軸対称度測定の系統誤差を小さく抑える事も必要である。最終的には shoulder module の測定結果より、現状のニュートリノビーム形状が及ぼす、SK におけるニュートリノフラックスの不定性を正しく見積もっていく。

6.4 本章のまとめ

本章で行った事以下にまとめる。

Run36の解析結果

shoulder module で得られた Run36 のデータの解析を行った。1日のニュートリノイベントレートは、平均で module14 で 9.20±0.048 (*stat.*)/10¹⁶ POT、module15 で 9.05±0.047 (*stat.*)/10¹⁶ POT と共に安定していた。またバンチごとのイベントレートではばらつきが最大で ±2.6% (module14)、±5.9%の範囲で安定している事を確認した。最後にニュートリノビームの非対称度 A(式 (6.1))を算出した結果、

$$A = 0.0080 \pm 0.0037 (stat.) \pm 0.0219 (sys.)$$

となった。

- 非軸対称なビーム形状で想定される Φ_{SK} の系統誤差
 - Re-weighting を用いて、様々な ρ において Φ_{SK} をシミュレートした。その結果 $\rho = -0.9$ とすると、SK におけるニュートリノピークエネルギー (0.5-0.7 GeV) のフラックスに 2.8%の不定性を与えてしまう事 が分かった。これはビーム方向を 1 mrad 間違えてしまったときの不定性とおよそ同程度である。
- シミュレーションによる Shoulder module における非対称度測定
 Re-weighting によって ρ を変えていき、shoulder module におけるビーム非対称度を見積もった。その 結果、ρ > 0 では shoulder module はビームの非軸対称に感度がない結果となった。
- データとシミュレーションの比較
 シミュレーションの結果を用いて、shoulder module とミューオンモニターの両方の測定結果より、それぞれ独立にρを求めた。その結果、

Shoulder module (A) : $\rho = -0.74 \pm 0.17 (stat.) \pm 0.57 (sys.)$ Muon monitor (A_{top}) : $\rho = 0.85 \pm 0.10 (sys.)$ (A_{bottom}) : $\rho = 0.34 \pm 0.05 (sys.)$ となり、どの ρ も有意に異なっていた。つまりシミュレーションはデータを再現していなかった事が分かった。

今後は shoulder module による非軸対称度の測定に対する系統誤差を小さく抑えていくと共に、シミュレーションの結果を理解していく。また、Re-weighting とは別に、電磁ホーン磁場を非軸対称の形にしてニュートリノビームの非軸対称を再現し、再びデータとシミュレーションの比較を行っていく。最終的には shoulder module の測定結果より、現状のニュートリノビーム形状が及ぼす、SK におけるニュートリノフラックスの不定性を正しく見積もっていく。

第7章 結論

T2K 実験は 2010 年の 1 月より物理ランが開始された。本論文では Run29 から 36 までのビームデータを ミューオンモニターを用いて解析を行った。その結果、物理ランにおけるニュートリノビームは、方向 1 mrad 以内、また強度で 3%以内という T2K が課した条件を十分に満たしている事が分かった。こうしてビームは 安定に供給できている事が保証され、振動解析に用いられる物理データの品質も保証できた。また、2010 年 の秋にインストールを行った INGRID shoulder module の性能評価試験を行い、Run36 のデータ解析により ビーム形状の非軸対称度を測定した。そして、シミューレーションでビームの形状を変え、この時の SK の ニュートリノフラックスの不定性を見積もった。その結果、相関パラメータ ρ = -0.9 の時には SK における ニュートリノのピークエネルギーに 2.8%の不定性を与える事が分かった。今後は shoulder module の測定結 果に与える系統誤差を小さく抑えるスタディをするとともに、シミュレーションで得られた shoulder module の非対称度測定結果の理解をする。また、Re-weighting 以外の方法でビーム形状が及ぼす SK のニュートリノフ ラックスの不定性を抑えていく。

謝辞

2009 年春に京都大学大学院に進学してから、今に至るまで時が経つのが早かったなと感じています。しか し同時に、およそ2年間という短い研究室生活の中で、本当に多くの方々にお世話になったなと痛感してい ます。

T2K 実験という世界的なプロジェクトに快く引き入れてくださった中家剛教授には、実験の基礎的な事か ら実践的な事まで、本当に多くの知識を授かりました。また論文執筆にあたっても、多くの指導と助言を頂 きました。本当に感謝しております。

市川温子准教授には常日頃、熱心な指導を頂きました。特に解析方針や実験計画においては本当にお世話に なりました。またミューオンモニターの運営においても気にかけて下さり、本当に感謝の気持ちで一杯です。

INGRID shoulder module の組み立て、インストールにおきましては、南野彰宏助教には大変お世話になり ました。検出器の組み立てに初心者な私に手取り足取りご指導を頂きました。また、shoulder module の解析 方針におきましても、多くの助言を頂きました。本当に有り難うございます。

2009 年 11 月に東京大学に栄転された横山将志准教授には、多くの事を学ばせて頂きました。また、栄転 された後でも、会う度に気にかけてくださり本当に有り難うございます。

松岡広大さんと久保一さんには、ミューオンモニターの運営、解析に至るまで、ここでは言い切れないほ どのたくさんのご指導を頂きました。自分がここまで来れたのも、偏に両先輩の熱心な指導のおかげといっ ても過言ではありません。本当に有り難うございます。

大谷将士さんと村上明さんには INGRID のデータ解析、シミュレーションについて些細な事まで懇切丁寧 に教えてくださいました。本当に有り難うございます。

高エネルギー加速器研究機構の中平武さん、坂下健さん、柴田政宏さんには、研究者としての姿勢を学ば せて頂きました。本当に有り難うございます。

最後に、研究室の皆さんのおかげで本当に有意義な2年間を送れました。ここに深く感謝の意を表したい と思います。

付録A 半導体検出器の特性

半導体のバンド構造

格子状に配列している原子が持つポテンシャルは周期的であり、これにより電子の取りうるエネルギーは バンド状となる。この時、電子が存在できないエネルギー領域は禁制帯、もしくはエネルギーギャップと呼ば れる。図 A.1 に典型的な不導体と半導体のエネルギーバンド構造を載せた。エネルギー準位の低いバンドは 価電子帯と呼ばれ、この準位にある電子は結晶格子に束縛されているため身動きが出来ない状態にある。一 方でエネルギー準位の高いバンドは伝導帯と呼ばれ、この準位にある電子は結晶格子内を自由に行き来でき る自由電子に相当する。半導体の場合、エネルギーギャップは不導体のそれよりも小さく、熱励起が可能で ある。電子が伝導帯へと励起する際、荷電帯には電子が不足した部分が生じる。この部分はホールと呼ばれ、 見かけ上、正の電荷が生じたととらえることが出来る。ガス中でイオン対が形成されることに似ており、半 導体ではこれをキャリア対が生成される、と呼ぶ。



図 A.1: 不導体と半導体のエネルギーギャップの違い

電場中におけるキャリアの移動

半導体に対し、ある方向へ電場をかけたとすると、電子は伝導帯へと励起し、電場方向と逆向きに移動す る。この電子が形成したホールは別の価電帯に存在する電子によって埋められ、さらにこの電子は元の位置 にホールを形成する。この操作が繰り返され、ホールは電子とは逆向き、つまり電場方向へ移動する。この 時、電子及びホールの移動速度は通常の熱運動に加え、電場によるドリフト速度を得る。ドリフト速度と電 場の関係式は次の通りである。

$$v_h = \mu_h E \tag{A.1}$$

$$v_e = \mu_e E \tag{A.2}$$

 v_h 、 v_e はそれぞれホール、電子のドリフト速度 (m/s) を、 μ_h 、 μ_e はそれぞれホール、電子の易動度 (m²/V·s) を表し、*E* は電場の大きさ (V/m) を表す。表 A.1 には 300 K(電離エネルギーに関しては 300 K と 77 K) にお ける Si と Ge の半導体としての特性を示した。

	Si	Ge
原子番号	14	32
質量数	28.09	72.60
密度 (g/cm ³)	2.33	5.32
エネルギーギャップ (eV)	1.115	0.665
電子の易動度 (cm²/V·s)	1350	3900
ホールの易動度 (cm²/V·s)	480	1900
電離エネルギー (eV) (300K)	3.62	-
電離エネルギー (eV) (77K)	3.76	2.96

表 A.1: 300 K における Si と Ge の半導体としての特性

ドーパントによる効果

不純物が含まれていない半導体は真性半導体と呼ばれ、これに対し意図的に不純物(ドーパント)を添加したものを不純物半導体と呼ぶ。この不純物半導体にはn型半導体とp型半導体の2種類が存在する。以下 Si を用いて説明を行う。

Si に微量のリン (P)、あるいはヒ素 (As) 等の5 価元素をドープしたものが n 型半導体である。これら不純物はドナー不純物と呼ばれる。図 A.2 に n 型半導体の場合の模式図と電子のエネルギー準位を載せた。不純物原子の最外殻には5 つの価電子が存在し、これが Si と結合することで1 つの余剰電子が生じる。この余剰電子はドナー電子と呼ばれ、図 A.2 の右側のように伝導帯付近にドナー準位を形成する。伝導帯とのエネルギー差が小さいため、この準位にあるドナー電子は容易に伝導帯への熱励起が可能となる。この結果、n 型半導体におけるキャリアの多くは電子によって担われるようになる。

一方でSiに微量のホウ素(B)、アルミニウム(Al)等の3価元素をドープしたものがp型半導体である。こ れら不純物はアクセプタ不純物と呼ばれる。図A.3にp型半導体の場合の模式図と電子のエネルギー準位を 載せた。アクセプタ不純物の場合、その周りには電子が1つ不足する状態となる。エネルギー準位は図A.3 の右側のようになり、価電子帯付近にアクセプタ準位を形成する。価電子帯とのエネルギー差が小さいため、 熱励起した電子はこのアクセプタ準位に容易に捕われ、ホールが形成されやすくなる。この結果、p型半導 体におけるキャリアの多くはホールによって担われる。





Valence Band

図 A.2: (左) 5 価元素である P が Si と結合した様子。P の周りに 1 つの余剰電子 (ドナー電子) が生じる (右) エネルギーギャップ間にドナー準位が形成される。



Conduction Band

Acceptor Level

Valence Band

図 A.3: (左) 3 価元素である B が Si と結合した様子。電子が 1 つ不足する状態となる。(右) エネルギーギャップ間にはアクセプタ準位が形成される。

pn 接合

p型半導体とn型半導体を接合すると、n層の伝導電子はp層へ拡散してホールと結合し、一方でp層の ホールはn層へと拡散し、伝導電子と結合する。すると接合面付近のn層は伝導電子が去っていったために、 ドナー不純物は正にイオン化し、一方でp層ではn層から流れ込んできた電子を受け取るため、アクセプタ 不純物は負にイオン化する。その結果、接合面付近ではこれらイオン化した不純物によって拡散を抑制させ る方向へ電場が生じる。こうして拡散は止まり、キャリアが存在しない空乏層が接合面に形成される。図A.4 はこれら一連の様子を模式的に表したものである。





図 A.4: (上) pn 接合時、n 層の伝導電子は p 層へ拡散してホールと結合し、一方で p 層のホールは n 層へ拡散 し伝導電子と結合する。(中央) キャリアの拡散によって、接合面付近の n 層では伝導電子が失われた状態とな るのでドナー不純物は正にイオン化し、逆に p 層のアクセプタ不純物は負にイオン化する。これらの電荷に よって生じる電場により拡散は止まり、その結果接合面付近でキャリアが存在しない領域「空乏層; depletion region」が生じる。(下) 空乏層を形成した後の電荷密度 ($\rho(x)$)の分布図。

pn 接合を施した半導体を検出器として用いる際、通常図 A.5 のように逆電圧を印加する。逆電圧を加えて ない状態だと、空乏層の厚みは小さくなり電気容量は増えるので、ノイズが大きくなってしまう。また、接 合によって生じる電位勾配(およそ1V)ではキャリアを移動させるのに不十分で、キャリアの再結合が起こ り、収集効率は悪くなってしまう。逆電圧を加えることにより、n層の伝導電子はp層へ、p層のホールはn 層へとさらに流れ込むため、結果として空乏層の厚みは大きくなり、またかけている電場によってキャリア のドリフト速度も早くなる(式 (A.1)及び式 (A.2))。図 A.6 に逆電圧を加えてない時の電子のエネルギー準 位(左図)、逆電圧(V)を加えているときの電子のエネルギー準位(右図)を載せた。







図 A.6: (左) 逆電圧がかかっていない時の電子のエネルギー準位。(右) 逆電圧 (V) がかかっている時の電子の エネルギー準位。

Fully Depleted Detectors

空乏層の厚みは以下の式で表される。

$$d \simeq \left(\frac{2\epsilon V}{eN}\right)^{1/2} \tag{A.3}$$

 ϵ は誘電率、Vは逆電圧の大きさ、eは素電荷、そしてNはドーパント密度であり、これはドナーもしくは アクセプタの内、ドーパントの量がより少ない方の密度を指す。この式より、空乏層の厚みを大きくするに は以下の2通りの方法がある。

- 逆電圧を大きくする。
- ドーパントの量をより少なくする。

最近では片方の層のドーパントの量を多くし (n⁺、p⁺)、もう一方の層では元々の結晶の純度を上げ、ドーパントの量を僅かしか添加しない n 型や p 型 (それぞれ v 型や π 型ともいわれる)を用いた半導体が主流となっている。この方法だと、空乏層は結晶純度の高い層へ伸びていき、多くドープされた方は非常に薄い層に出来上がる。図 A.7 に p⁺ 型に結晶純度の高い n 型のウェーハを接合した半導体を示した。この半導体に加える逆電圧を大きくしていった場合、ある電圧時にはウェーハ全体に空乏層が広がる。この時の電圧は Depletion Voltage と呼ばれ、式 (A.3) から次の式で表される。

$$V_d = \frac{eNT^2}{2\epsilon} \tag{A.4}$$

*T*はウェーハの厚さであり、これは空乏層の厚さに等しい。さらに逆電圧を大きくしていくとウェーハに 対し、電場は一様分布に近づく。こうすることでウェーハの至るところで一定以上の電場が得られ、検出器 全体が Active Volume となる。このような検出器を Fully Depleted Detector と呼ぶ。

図 A.8 に様々な Fully Depleted Detector とそれぞれに対応する電場分布を示した。中央に位置するタイプは PIN 構造を表し、これは薄い n⁺ 層と p⁺ 層の間に真性層 (i 層) をウェーハとして挟んだもので、こうする事 により低い電圧で fully depleted な状態を得られる。またウェーハの至る所で電場分布が一様となるのが特徴 である。我々がミューオンモニターに使用している s3590-08 (最大印加電圧: 100 V) もこの PIN 構造をとっ ており、実験では 80 V を印加し fully depletion を起こして用いている。



図 A.7: (上) 薄い p⁺ 層と結晶純度の高い n 型を接合したもの。(下) 電場分布: Depletion Voltage (V_d) より低い 逆電圧、等しい逆電圧、そして高い逆電圧の 3 つをプロットしたもの。



図 A.8: 様々な Fully Depleted Detector とその電場分布

付録B MPPCの特性

INGRID に使用している半導体検出器「MPPC」の主な特性を以下に記した。

ゲイン

MPPCを使用する際、通常ガイガーモードで使用する。このモードでは、APD に光子が入射し、生成され た電子・ホール対がガイガー放電を起こし、約 10⁶ 倍され、各ピクセルで1 個の光子を検出することが可能 になる。このときの増幅率をゲインと呼ぶ。ゲインは元々一つの光電子が APD ピクセル内部でどのくらいの 電荷量まで増倍されたかで定義され、ブレイクダウン電圧からの印加電圧差 (ΔV) に依存する。

ノイズ

MPPC は以下の2つの原因により、ノイズが生じる。

熱電子
 熱励起によってエネルギーギャップ (~1.1 eV) を超える電子によりキャリア対が生じる。それがゲインで増幅され、シグナルと区別できないノイズを生む。したがって温度が上昇するにつれ、熱電子によるノイズレートが大きくなる。

トンネル効果

逆電圧をかける事で、p型半導体の価電子帯の電子が、n型半導体の伝導帯へトンネル効果により入り、 そこで新たなキャリア対を作ってしまう。しかし、この効果は温度に依存しないため、常温で使用する 際、このノイズの寄与は熱電子ノイズの寄与に比べはるかに小さい。

INGRID は 20°C、 $\Delta V = 1.0$ で MPPC を使用しており、この時のノイズレートは 500 MHz である。

クロストーク・アフターパルスレート

クロストークは、ある APD ピクセルで発生した電子・ホール対の増倍過程で発生する二次的な光子が隣の ピクセルで検出される現象である。一方、アフターパルスは、増幅過程の途中で増幅された電子の一部が半 導体中の格子欠陥にトラップされ、一定時間後解放された電子が再び増幅過程を引き起こす現象である。

付 録 C シミュレーション

C.1 T2K ビームラインシミュレーション: JNUBEAM

JNUBEAM は GEANT3 をベースとしたシミューレーションであり、以下の手順に沿ってニュートリノフ ラックスを生成させる。30GeV の陽子を炭素標的と衝突させ、ハドロン生成モデルの FLUKA2008[13, 14] を 用いてハドロン (π^{\pm} 、K[±]、K⁰) を生成させる。炭素標的より抜けたこれら粒子を電磁ホーンの磁場によって収 束させる。その際、炭素標的の外部 (電磁ホーンの内部導体等) と反応する粒子には別のハドロン生成モデル である GCALOR [15] を用いている。こうして得られた粒子は崩壊トンネルまでトレースさせ、そこでニュー トリノに崩壊させる。表 C.1 はニュートリノ (ν_{μ} 、 ν_{e}) を生成させる際に JNUBEAM で用いている親粒子の分 岐比である。生成したニュートリノは前置検出器、SK まで外挿させ、そこでのフラックス及びニュートリノ スペクトルを求めている。図 C.1 は JNUBEAM によって求められた SK におけるニュートリノスペクトルで ある。

表 C.1: JNUBEAM で用いているハドロン粒子のニュートリノへの分岐比

		親粒子	
	π^+	K^+	${ m K}_L^0$
ν_{μ}	$\mu^+ u_\mu$	$\mu^+ u_\mu, \pi^0 \mu^+ u_\mu$	$\pi^-\mu^+ u_\mu$
(%)	99.9877	63.55,3.353	27.04
v_e	$e^+ v_e$	$\pi^0 e_+ \nu_e$	$\pi^- e^+ \nu_e$
(%)	1.23×10^{-4}	5.07	40.55

C.2 ニュートリノ反応シミュレーション:NEUT

ニュートリノ反応シミュレーション「NEUT」では、ニュートリノと原子核の核子との相互作用をシミュ レートし、生成された二次粒子の情報を得ることができる。INGRIDの構成はほぼ鉄のため、NEUTを用いて シミューレーションする際はニュートリノと鉄との反応のみを考慮している。この時、NEUTでシミュレー トされる主な反応を以下に挙げた。

- 荷電カレント準弾性散乱 (CC-QE): ν + N → l + N'
- 荷電カレント 1π 生成反応 (CC- 1π): $\nu + N \rightarrow l + N' + \pi$



図 C.1: JNUBEAM でシミューレートした SK におけるニュートリノエネルギースペクトル

- 荷電カレントコヒーレント π 生成反応 (CC-1 π): ν +¹⁶ $O \rightarrow l$ +¹⁶ $O + \pi$
- 荷電カレント深非弾性散乱 π 生成反応 (CC-DIS): $\nu + N \rightarrow l + N' + multi \pi$
- 中性カレント弾性散乱 : $v + N \rightarrow v + N'$
- 中性カレント 1π 生成反応 : $\nu + N \rightarrow \nu + N' + \pi$
- 中性カレントコヒーレント π 生成反応: ν +¹⁶ $O \rightarrow \nu$ +¹⁶ $O + \pi$
- 中性カレント深非弾性散乱: $v + N \rightarrow v + N' + multi\pi$

JNUBEAMによって、求めたい位置におけるニュートリノフラックスを生成し、NEUTを通すことで、ニュートリノエネルギーの関数としての反応数を求めることができる。

付録D T2K実験の現状

T2K における v_e 出現事象の現状について述べる。2010 年 1 月から 6 月末まで行われた物理ランで、 3.23×10¹⁹ POT (Proton On Target)の統計量を獲得した。SK における v_e 事象の証拠となる反応モードは次 の荷電カレント準弾性散乱 (CCQE) による反応である。

$$v_e + n \to e^- + p \tag{D.1}$$

この反応によって生じる電子のイメージリングを測定し、v_e 出現事象を確かめている。以下は SK で用いられている v_e 出現事象イベントに与えているイベントセレクションである。

1. Fully-containd fiducial volume cut (FCFV)

宇宙線 μ 粒子や、中で反応して生じたレプトンが外に逃げるようなイベントを除去するため、Outer detector(OD) で 16 以上の PMT にヒットが無い事を要求する。続けて、SK で定められた Fiducial volume (水タンク内部の壁から 200 cm 以上) 内に反応店がある事を要求する。

- 2. Visible energy $(E_{vis}) > 100$ MeV リングイメージより再構成した時のエネルギーが 100 MeV 以上であることを要求する。これにより、 中性カレント反応や μ 粒子の Micheal 崩壊によって生じた低いエネルギーの電子によるイベントを除去 する。
- 3. Number of rings (N_{rings}) = 1 チェレンコフリングが 1 つである事を要求する事によって、CCQE-1 π ($\nu_{\mu} + p \rightarrow \mu^{-} + n + \pi^{0}$) からの $\pi^{0} \rightarrow 2\gamma$ による Multi ring なイベントを除去し、CCQE を同定する。
- Electron-like ring identified by PID algorithm
 SK で定められたアルゴリズムによって、リングイメージが電子のものかどうかを要求する。
- 5. Reconstructed invariant mass $< 105 \text{ MeV/c}^2$

 π^{0} からの 2 γ から生じた 2 つのリングイメージであっても、その内の 1 つを同定できず、誤って 3. の 条件を満たしてしまう恐れがある。こういった事を防ぐため、あらかじめ検出したリングが π^{0} からの 2 γ であると仮定し、SK で定められたアルゴリズム (POLfit: Patter Of light FIT)を用いて不変質量を再 構成する。ここで 105 MeV/c² 以下である事を要求する。

6. Reconstructed neutrino energy (E_{ν}^{rec}) < 1250 MeV Off-Axis 法の効果によって、 ν_{μ} のエネルギースペクトルは 600 MeV 当たりにピークを持つ。再構成し たニュートリノエネルギーが 1250 MeV 以下である事を要求し、 ν_{e} 事象測定の purity を上げる。

このイベントセレクションによって、2010a データではただ1つ*v*e 出現事象と見られる電子のリングイメージが見つかった。図 D.1 にこのイベントディスプレイを載せた。



図 D.1: v_e 出現事象のイベントディスプレイ。電子によるチェレンコフリングイメージが見える。

参考文献

- [1] F. Reines and C.L. Rowan et al., "Detection of the Free Antineutrino", Phys. Rev. Vol.117, No.1 (1960).
- [2] Z. Maki, M. Nakagawa, and S. Sakata *et al.*, "Remarks on the unified model of elementary particles", Prog. Theor. Phys., Vol.28, p.870 (1962).
- [3] Y. Fukuda *et al.* [Super-Kamiokande Collaboration], "Evidence for oscillation of atmospheric neutrinos", Phys. Rev. Lett. Vol.81, No.8 (1998).
- [4] E. Aliu *et al.* [K2K Collaboration], "Evidence for muon neutrino oscillation in an accelerator-based experiment", arXiv:hep-ex/0411038.
- [5] Y. Itow et al., "The JHF-Kamioka neutrino project", arXiv:hep-ex/0106019.
- [6] 久保 一, "NuMI ニュートリノビームラインを用いた T2K 実験ミューオンモニターの長期試験 (FNAL T968 実験)", 修士論文, 京都大学大学院理学研究科 (2008).
- [7] 松岡 広大, "T2K 長基線ニュートリノ振動実験 ミューオンモニターの開発", 修士論文, 京都大学大学院理 学研究科 (2007).
- [8] D. H. Wilkinson, "IONIZATION CHAMBERS AND COUNTERS", Cambridge Univ. Press, (1950).
- [9] ROOT- A Data Analysis Framework; http://rooc.cern.ch/.
- [10] 永井 直樹, "T2K 実験において用いられる半導体光検出器 MPPC の大量測定", 修士論文, 京都大学大学院 理学研究科 (2009).
- [11] GEANT- Detector Description and Simulation Tool, Application Software Group, Computing and Networks Division, CERN, Geneva (1993).
- [12] Y. Hayato, "NEUT," Nucl. Phys. Proc. Suppl. Vol.112, p.171 (2002).
- [13] G. Batteistoni, S. Muraro, P.R. Sala, F. Cerutti, A.Ferrari, S. Roesler, A. Fasso, J.Ranft, "The FLUKA code: Description and benchmarking", Proceedings of the Hadronic Shower Simulation Workshop 2006, Fermilab 6-8 september 2006, M.Albrow, R. Raja eds., AIP Conference Proceedings 896, 31-49 (2007).
- [14] A. Fasso, A. Ferrari, J. Ranft, and P.R. Sala, "FLUKA: a multi-particle transport code", CERN-2005-10 (2005), IFND/TC_05/11, SLAC-R-773.
- [15] C. Zeitinitz and T. Gabriel, Proc. of International Conference on Calorimetry in High Energy Physics, Tallahasse, FL, USA, Feburary, 1993.

- [16] 村上 明, "ミューオンビームモニター及びニュートリノビームモニターによる T2K 実験ニュートリノビー ムの評価", 修士論文, 京都大学大学院理学研究科 (2010).
- [17] 平出 克樹, "J-PARC ニュートリノ振動実験のための off-axis 前置検出器の基本設計および APD 読み出し 系の開発", 修士論文, 京都大学大学院理学研究科 (2005).
- [18] 栗本 佳典, "T2K 実験におけるニュートリノビームモニターの開発", 修士論文, 京都大学大学院理学研究 科 (2006).